

【別表1-2】各エリアの特殊条件

エリア(室名)			用途	特殊条件	備考	
棟	階	番号				
d	B3	1	集中監視室	<p>RI施設に法令が要求するモニタ、RI従事者の入室管理システム、排気操作盤、排水操作盤、各種警報機などを設置し、集中監視するための部屋。また、放射線取扱主任者が法定帳簿の管理、保管、利用者の教育訓練を行う。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 一般区域 部屋は地下2階入口付近に配置。 モニタは法令が要求する基準を満たすものとし、排気中濃度と排風機積算時間は少なくとも必要。 排気系操作、排水系操作はローカル、リモート切替可とし、この部屋からリモート操作できること。 入室管理システムを備え、管理区域(5箇所)への入室退室及び放射線区域(下限数量以下のRIを使用する部屋)1箇所への入室を自動で記録できること。記録項目は氏名、部屋名、年月日、入室時刻および退室時刻である。メニューを選択する形式で日報(個別および指定された範囲の連続)をA4紙に出力できること。日報のヘッダ、フッタ、部屋名称は利用者が設定できるようにすること。 モニタ出力、排気系・排水系の状態、入室状況、各種警報の情報はLAN経由で遠隔監視できること。 各種警報はe-mailで発信できるようにすること。 扉: W1,250mm(親子開き) 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 給湯設備: 電気温水器 出入り口扉付近に腰窓を設ける LAN 電気錠(3箇所)の集中管理ができること。 	
d	B3	2	共同利用者室	<p>RI施設の管理区域には必要最小限の物しか持ち込めないことから、この部屋で身の回りの品を一時的に置き、データ整理などの作業を行う。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 一般区域 集中監視室付近に配置 扉: W1,250mm(親子開き)電気錠付 LAN 電気錠は集中監視室で制御 	
d	B3	3	保管室	<p>RI施設で使用する薬品やRI施設の保守に必要な備品、消耗品を保管する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 一般区域 扉: W1,250mm(親子開き) 床: 耐薬品性ビニルシート等。 防火区画とする。 ドラフトチャンバー: 幅1200 湿式スクラパー付 カードリーダーを出入口扉付近入室用に設置 その他: 酸素濃度計(液体窒素) LAN 	
d	B3	4	ヘリウム回収室	<p>ヘリウム回収設備(ガスバッグ、圧送ポンプ、オイルミストトラップ、操作盤、流量計、情報端末、酸素濃度警報装置等)を設置、ヘリウム回収端末も1カ所設置。 ガスバッグ容量は5m3以上。 圧送ポンプでヘリウムガスをAクラスまで圧送。 ウェイトがスムーズに動き、エラーが起きないこと。 1m3/min程度の流入が長時間継続しても、速やかに圧送を開始し、トラブルが起きないこと。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 一般区域 10m3程度のガスバックからなるヘリウム回収設備を設置可能とする。 設計については関係部局(低温物質科学センター等)および低温研究者(液体ヘリウムユーザー)の承認を得ること。 LAN、電話、100V15A×2のコンセントを設けること。 扉: W850mm×H2,000mm(片開き) 酸素濃度計 	
d	B3	5	計測準備室	<p>RIを使用しない各種計測準備、試料調整、データ処理等を行う。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 一般区域 扉: W1,250mm(親子開き) 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 実験用ステンレス製流し 実験排水: 一般実験 防火区画 LAN 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
d	B3	6	X線計測室	<p>エックス線装置を設置し、物質の構造解析実験等を行う。電離則の放射線装置室である。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 一般区域(ただし放射線装置室) 部屋の入口(廊下側)にエックス線装置の電源に連動した運転表示灯を設置し、信号線を分電盤まで配線すること。 扉: W1,250mm(親子開き) 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 実験排水: 一般実験 防火区画 機器冷却水 LAN 	
d	B3	11	汚染検査室	<p>RI施設において汚染の有無を確認し、汚染があった場合は洗浄するために設けることが法令で義務づけられている部屋。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 汚染検査室は管理区域、入退室管理室は放射線区域(下限数量以下のRI使用区域) 入退室管理室と汚染検査室に分け、一般区域への出入口は入退室管理室側に配置 両室境界には下限数量以下のRIを受け渡すことができるパスボックスと自動扉を設ける 入退室管理室は放射線区域に通じ、出入口に自動扉を設ける 2つの自動扉は入退室管理システムと連動させる 2つの部屋は履物を替えられるように一段高い床にする 汚染検査室にはハンドフットクロスモニタとシャワー室を設置し、管理区域への出入口を設ける 管理区域と放射線区域の間には常時閉の緊急時用扉を設け、管理区域側からサムターンカバーにて容易に開けられるようにする 扉: H2,000mm × W850mm(片開き) 室仕様についてはRI施設としての基準を満たすこと。 洗濯機パン+給排水 実験排水: RI 照明器具: アクリルルーバ付 排気系には高性能フィルターを設置 温度制御は室内循環空調とし、RI排気系は温度制御はしない。 空調温度制御は補助的に室内循環空調とし、RI給気系はオールフレッシュ分のみの温度制御とする。 実験用ステンレス流し(管理区域出入口扉付近)1台 カードリーダーは管理区域出入口扉に入域用と退域用の2台を、放射線区域入域用の1台を設置 床は塩ビ系長尺シートとし、巾木巻上は150mm 壁、天井の仕上げはクリーンクロスとし、目地は専用のテープを貼ること エアコンのドレンはRI排水に導くこと LAN 	
d	B3	12	貯蔵室	<p>密封及び非密封RIの保管を行う。このため、法令上の貯蔵室としての基準を満たす必要がある。耐火能力を持つ鉄筋コンクリート造りとし、出入口扉は特定防火設備に該当する防火戸。給排気ダクトには防火ダンパーを設ける。鉛5cmの保管庫及び貯蔵室周囲30cm厚の鉄筋コンクリート壁などにより、人が常時立ち入る場所で1mSv/週を超えないこと。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 管理区域 バリアは下履き履き替えのための一時的な障壁であり、設計に含めなくてよい。 扉: 特定防火設備に該当する防火戸であり、特定の登録者のみ開閉可能とする施錠機構を有すること。 鉄筋コンクリート30cm相当の遮蔽性能を有すること。 照明器具: アクリルカバー付 排気系には高性能フィルターを設置 空調温度制御は補助的に室内循環空調とし、RI給気系はオールフレッシュ分のみの温度制御とする。 実験用ステンレス流し(管理区域出入口扉付近)1台 出入口扉は電気錠を設置し、電気錠は集中監視室で制御 床は塩ビ系長尺シートとし、巾木巻上は150mm 壁、天井の仕上げはクリーンクロスとし、目地は専用のテープを貼ること。 給排気ダクトには防火ダンパーを設ける(耐火構造)。 鉛5cmの保管庫及び30cm厚相当のコンクリート壁の囲いなどにより、人が常時立ち入る場所で1mSv/週を超えないこと。 RI核種の貯蔵数量はその核種の年間使用予定数量とする。 エアコンのドレンはRI排水に導くこと。 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
d	B3	13	廃棄物保管室	<p>廃棄するRI及びRIIに汚染された物品を保管する。このため法令上の保管廃棄設備としての基準を満たす必要がある。</p> <p>耐火能力を持つ鉄筋コンクリート造りとし、出入り扉は特定防火設備に該当する防火戸。給排気ダクトには防火ダンパーを設ける。周囲30cm厚のコンクリート壁などにより、人が常時立ち入る場所で1mSv/週を超えないこと。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・管理区域 ・扉: 特定防火設備に該当する防火戸であり、特定の登録者のみ開閉可能とする施錠機構を有すること。 ・空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 ・照明器具: アクリルカバー付 ・排気系には高性能フィルターを設置 ・空調温度制御は補助的に室内循環空調とし、RI給気系はオールフレッシュ分のみの温度制御とする。 ・実験用ステンレス流し(管理区域出入口扉付近)1台 ・出入口扉は電気錠を設置し、電気錠は集中監視室で制御 ・床は塩ビ系長尺シートとし、巾木巻上は150mm ・壁、天井の仕上げはクリーンクロスとし、目地は専用のテープを貼ること。 ・給排気ダクトには防火ダンパーを設ける(耐火構造)。 ・30cm厚のコンクリート囲いなどにより、人が常時立ち入る場所で1mSv/週を超えないこと。 ・RI核種の保管廃棄数量はその核種の年間使用予定数量とする。 ・エアコンのドレンはRI排水に導くこと。 	
d	B3	14	排水処理室	<p>RI施設において実験排水やクーラー凝縮水を一旦貯留し、必要があれば希釈するための部屋。法令で設置が義務づけられている。</p> <p>貯留槽(実容積10ton)×2槽、希釈槽(実容積10ton)1槽</p> <p>他に床下ピットに集合槽(容積1ton)を設け、貯留槽にポンプアップすること</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・管理区域 ・貯留槽と希釈槽それぞれの台数と容積は、本RI施設が使用する核種と数量を考慮し、適正な規模にすること。 ・排水モニタは必要であれば設けること。 ・貯留槽および希釈槽の水数100ccを容易にサンプリングできるようにすること。 ・管理区域内の排水は、法令の基準に従ってこの排水処理室に集め、適正に処理できるようにすること。 ・貯水量の常時モニタ、排水のローカル及びリモート操作ができるようにすること。 ・貯留槽および希釈槽はステンレス鋼製タンク式にすること。 ・各槽の配置や操作盤の位置、大きさなどは適切なものとする。 ・扉: W1,250mm(親子開き) ・室仕様についてはRI施設としての基準を満たすこと。 ・ドラフトチャンバー: 幅1500 湿式スクラパー付 ・排気系には高性能フィルターを設置 ・ステンレス流し(管理区域出入口扉付近)1台 ・床下ピットには集合槽を設置する ・床は防水塗料仕上 塗装巾木は150mm、床ドレンを設け床下ピット内の集合槽へ導くこと。 ・出入り口扉付近に防液堤を設け槽からあふれた排水の流出を防止すること。 ・管理空域内床下ピットは区画し、区画内の湧水等はピット内に設置するポンプにて集合槽へ汲み上げること。 	
d	B3	15	排水貯留室	<p>下限数量以下の密封されていないRIを使用する部屋の排水を一旦貯留し、安全のために濃度を測定してから放水するための部屋。</p> <p>貯留槽(実容積5ton) 2槽を設置する。</p> <p>床下のピット内に集合槽(容積1ton) 1槽を設置、貯留槽へポンプアップする。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・下限数量以下のRI区域 ・貯留槽の台数や容積は、下限数量以下のRI実験室が使用する核種と数量を考慮し、適正な規模にすること ・貯留槽の水数100ccを容易にサンプリングできること ・下限数量以下のRI実験室内の排水は、この排水貯留室に集めること ・貯水量の常時モニタ、排水のローカル及びリモート操作ができるようにすること ・貯留槽はステンレス鋼製タンク式であること ・各槽の配置や操作盤の位置、大きさなどは適切なものとする。 ・扉: W1,250mm(親子開き) ・実験用ステンレス流し ・排水: 放射線区域系(下限数量以下系)RI排水 ・貯留槽(実容積5ton) 2槽を設置する。 ・床下のピット内に集合槽(容積1ton) 1槽を設置、貯留槽へポンプアップする。 ・床は防水塗料仕上 塗装巾木は150mm、床ドレンを設け床下ピット内の集合槽へ導くこと ・出入り口扉付近に防液堤を設け槽からあふれた排水の流出を防止すること。 	

エリア(室名)			用途	特殊条件	備考	
d	B3	16	排気機械室	<p>【排気機械室】</p> <p>RI施設に外気を導入し、施設内の空気を、必要に応じてフィルターを通りして排気するための機械を設置する部屋。法令で機械の設置が義務づけられている。</p> <p>施設内の空気を排気するポンプやフィルターユニットは管理区域に収めること。</p> <p>エアコンなどの空調機を設置してもよいが、管理区域とは壁で分けて別の部屋にすること。</p>	<p>【排気機械室】</p> <ul style="list-style-type: none"> 排気ポンプ、フィルターユニットを設置する一画は管理区域とし、壁などで他の一般区域と区別すること。 給気ポンプ、排気ポンプ、空調機、各種フィルター類は、使用する核種と数量を考慮し、適正な規模にすること。 チャコールフィルタは使用しないこと。 排気モニタを設けること。 集中配管方式で作業環境測定できるサンプリングポートを排気系(フィルタの前)に設けること。 管理区域内の空気はこの排気機械室に集め、法令の基準を満たすように処理すること。 機器の運転状況と異常の有無のモニタ、操作のローカル及びリモート切替え、排気ポンプの積算運転時間の表示ができること。 管理区域の作業室については1室につき1給排気系となるようにすること。廊下や汚染検査室、貯蔵室など常時換気が必要な場所は給排気系をまとめても構わない。 機器の配置や操作盤の位置、大きさなどは適切なものとする。 一般区域には給気ポンプ(フィルタを含む)、空調機を置いてよい。 扉: W1,250mm(親子開き)入退室管理システムに接続された防音仕様。 室仕様についてはRI施設としての基準を満たすこと。 扉: 防音仕様 壁・天井に吸音対策(グラスウールマット等)。 実験排水: RI 機械室との仕切はH2000以上のフェンスとし、出入り口は1200以上の扉とすること。 使用する空調システムは省エネルギー、ランニングコストに配慮すること。 	
d	B3	17	機械室			
d	B3	18	測定室	<p>非密封RIの管理区域であり、実験試料の極低バックグラウンド放射能測定などを行う。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 管理区域 RI施設内の全種類の非密封RIを1日最大使用数量の1/10だけ持ち込み、測定できるように排気量や遮蔽などを設計すること。 液体試料や揮発性試料はバイアル瓶などに気密に封入して測定する。 機器等調査表に掲げた装置のうち、配置図に記載の無いものは、適宜実験台上で移動して用いる。 扉: W1,250mm(親子開き) 室仕様についてはRI施設としての基準を満たすこと。 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 実験用ステンレス製流し(実験容器洗浄・排水のため) 実験排水: RI その他: 酸素濃度計(液体酸素) 照明器具: アクリルカバー付 排気系には高性能フィルターを設置 空調温度制御は補助的に室内循環空調とし、RI給気系はオールフレッシュ分のみ温度制御とする。 床は塩ビ系長尺シートとし、巾木巻上は150mm 壁、天井の仕上げはクリーンクロスとし、目地は専用のテープを貼ること 防火区画 エアコンのドレンはRI排水に導くこと シンダキャビネット(可燃ガス)が設置するため、排気系にダクトが接続できるようにすること LAN 	

エリア(室名)		用途	特殊条件	備考	
d	B3	21	重同位体実験室	<p>非密封RIの管理区域であり、RIトレーサを用いた化学実験、高温熔融塩反応実験、放射能測定などを行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・非密封RI管理区域 ・特別な遮蔽を設けなくてもRIを使用できるようにすること。その際に核種の数量を変更する場合は事前に相談すること。 ・扉: W1,800mm(両開き) ・室仕様についてはRI施設としての基準を満たすこと。 ・空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 ・実験用ステンレス製流し(実験容器洗浄・排水のため) ・実験排水: RI ・Cl-36, Cr-51, Fe-55, Fe-59, Co-60, Ni-63, Cu-64, Se-75, Zr-95, Tc-99, I-125, Ce-141, Eu-152, Eu-154, Gd-153(15核種でいずれも1日/3月/年間最大数量は1MBq/92MBq/370MBq)、V-48, Mn-52, Co-56, Sr-90, Cs-134, Cs-137(6核種はいずれも1日/3月/年間最大数量は1MBq/37MBq/37MBq)、および、H-3, C-14(2核種でいずれも1日/3月/年間最大数量は10MBq/920MBq/3700MBq)の非密封RIを利用する予定であるため、関連する法令の基準を満たすこと。 ・照明器具: アクリルカバー付 ・排気系には高性能フィルターを設置 ・空調温度制御は補助的に室内循環空調とし、RI給気系はオールフレッシュ分のみの温度制御とする。 ・実験用ステンレス流し1台 ・床は塩ビ系長尺シートとし、巾木巻上は150mm ・壁、天井の仕上げはクリーンクロスとし、目地は専用のテープを貼ること。 ・危険物取扱所用防火区画 ・ドラフトチャンバー: 幅1800 湿式スクラーパー付 ・エアコンのドレンはRI排水に導くこと。 ・グローブボックス2台使用 ・実験用分電盤(3相200V30A、単相100V40A)を1箇所設けること。 ・LAN ・特殊換気として 真空ポンプ排気接続用NW-40ステンレス配管継手を設けること。 	
d	B3	22	同位体実験室	<p>非密封RIの管理区域であり、RIトレーサを用いた溶液化学実験、放射能測定などを行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・非密封RI管理区域 ・特別な遮蔽を設けなくてもRIを使用できるようにすること。その際に核種の数量を変更する場合は事前に相談すること。 ・扉: W1,800mm(両開き) ・室仕様についてはRI施設としての基準を満たすこと。 ・空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 ・実験用ステンレス製流し(実験容器洗浄・排水のため) ・実験排水: RI ・Cl-36, Cr-51, Fe-55, Fe-59, Co-60, Ni-63, Cu-64, Se-75, Zr-95, Tc-99, I-125, Ce-141, Eu-152, Eu-154, Gd-153(15核種でいずれも1日/3月/年間最大数量は1MBq/92MBq/370MBq)、V-48, Mn-52, Co-56, Sr-90, Cs-134, Cs-137(6核種はいずれも1日/3月/年間最大数量は1MBq/37MBq/37MBq)、および、H-3, C-14(2核種でいずれも1日/3月/年間最大数量は10MBq/920MBq/3700MBq)の非密封RIを利用する予定であるため、関連する法令の基準を満たすことが必要である。 ・照明器具: アクリルカバー付 ・排気系には高性能フィルターを設置 ・空調温度制御は補助的に室内循環空調とし、RI給気系はオールフレッシュ分のみの温度制御とする。 ・実験用ステンレス流し1台 ・床は塩ビ系長尺シートとし、巾木巻上は150mm ・壁、天井の仕上げはクリーンクロスとし、目地は専用のテープを貼ること ・危険物取扱所用防火区画 ・ドラフトチャンバー: 幅1800 湿式スクラーパー付 ・特殊換気として 真空ポンプ排気接続用NW-40ステンレス配管継手を設けること。 ・エアコンのドレンはRI排水に導くこと。 ・グローブボックス1台使 ・LAN 	

エリア(室名)			用途	特殊条件	備考	
d	B3	23	中性子実験室	<p>密封RI中性子源を用いた物理実験、検出器開発および校正を行う。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 管理区域(密封線源) 扉:W:1,800mm(両開き) 室仕様については密封RI施設としての基準を満たすこと。 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 実験用ステンレス製流し(実験容器洗浄・排水のため) 実験排水:一般 本室で使用する密封RI中性子源(241Am-Be中性子源)の数量は2個で、それらの強度は、それぞれ、1.11GBq, 18.5GBqである。各線源からの線量率は以下のとおりである。 18.5GBqAm-Be線源の1cm線量当量率 使用時:78.2 μ Sv/h(@50cm), 貯蔵時:5.59 μ Sv/h(@貯蔵容器表面) 1.11GBqAm-Be線源の1cm線量当量率 使用時:4.69 μ Sv/h(@50cm), 貯蔵時:0.335 μ Sv/h(@貯蔵容器表面) 危険物取扱所用防火区画 カードリーダを出入口扉付近入室用、退室用の2台を設置 LAN 	
d	B3	24	線源物理実験室	<p>密封RI線源を内蔵した水分計を用いて、各種材料の非破壊分析を行う。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 管理区域 扉:W2,000mm必要である 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 実験排水:一般 実験用ステンレス製流し 実験排水:RI 使用する線源は 密封線源:水分計(Am-241 3.7GBq) 室仕様については密封RI施設としての基準を満たすこと。 危険物取扱所用防火区画 カードリーダを出入口扉付近入室用、退室用の2台を設置 LAN 	
d	B3	25	微量放射能測定室	<p>下限数量以下の使用室であり、各種物理化学実験、放射能測定などを行う。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 下限数量以下のRI使用室 扉:W1,800mm(両開き) 室仕様についてはRI施設としての基準を満たすこと。 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ドラフトチャンバー:幅1800 湿式スクラパー付1台 実験用ステンレス製流し(実験容器洗浄・排水のため) 実験排水:放射線区域系(下限数量以下系)RI排水 使用予定核種と数量は、H-3(1GBq),Ni-63(100MBq),C-14,Cr-51,Ce-141,Gd-153(10MBq),Cl-36,Fe-55,Fe-59,Cu-64,Zr-95,Eu-152,Eu-154(1MBq),V-48,Mn-52,Co-56,Co-60(100kBq),Cs-134,Cs-137(10kBq)であり、関連する法令の基準を満たすことが必要である。 照明器具:アクリルカバー付 床は塩ビ系長尺シートとし、巾木巻上は150mm 壁、天井の仕上げはクリーンクロスとし、目地は専用のテープを貼ること。 危険物取扱所用防火区画 その他:酸素濃度計(液体窒素) 特殊換気として 真空ポンプ排気接続用NW-40ステンレス配管継手を設けること。 エアコンのドレンは放射線区域系(下限数量以下系)RI排水 に導くこと。 可燃ガス使用によるシリンダキャビネット(ドラフトに接続口)を設けること。 LAN 機器冷却水 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
d	B3	26	同位体実習室	<p>下限数量以下の使用室であり、各種物理化学実験、放射能測定などを行う。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・下限数量以下の使用室 ・扉:W1,800mm(両開き) 廊下側に1ヶ所 ・室仕様についてはRI施設としての基準を満たすこと。 ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・ドラフトチャンバー:幅1800 湿式スクラパー付 2基 ・実験用ステンレス製流し(実験容器洗浄・排水のため)2台 ・実験排水:放射線区域系(下限数量以下系)RI排水 ・使用予定核種と数量は、H-3(1GBq),Ni-63(100MBq),C-14,Cr-51,Ce-141,Gd-153(10MBq),Cl-36,Fe-55,Fe-59,Cu-64,Zr-95,Eu-152,Eu-154(1MBq),V-48,Mn-52,Co-56,Co-60(100kBq),Cs-134,Cs-137(10kBq)であり、関連する法令の基準を満たすこと。 ・照明器具:アクリルカバー付 ・実験用分電盤(3相200V30A、単相100V30A)を1箇所設けること。 ・床は塩ビ系長尺シートとし、巾木巻上は150mm ・壁、天井の仕上げはクリーンクロスとし、目地は専用のテープを貼ること。 ・危険物取扱所用防火区画 ・特殊換気として 真空ポンプ排気接続用NW-40ステンレス配管継手を設けること。 ・エアコンのドレンは放射線区域系(下限数量以下系)RI排水に導くこと。 	
d	B3	27	検出器開発室	<p>下限数量以下の密封線源を用いて、放射線検出器の開発、放射線検出器の校正などを行うほか、天然物質から放出される放射線の測定を行う。また、種々のX線源を用いて、材料分析などを行い、また、CTなどのX線透過撮影法に関する研究を行う。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・一般区域 ・部屋は中でパーティションで区切り、それぞれに空調を設けること。 ・扉:W1,250mm(親子開き) 幅は搬入口1,800mmの2箇所必要である。 ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・実験用ステンレス製流し 2台 ・実験装置用給排水(20℃ 10L/min) ・特殊ガス配管:He回収(メーター設置) 部屋の向かい合った壁に2箇所 ・危険物取扱所用防火区画 ・その他:酸素濃度計(液体窒素) ・LAN 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
d	B3	31	分子標識実験室	核酸やタンパク質、その他生体分子をRIで標識し、様々な研究に用いる。非密封の放射性同位元素を使用する。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理区域、P1区域 ・扉:W1,800mm(両開き) ・部屋には、暗室、低温室を含む ・床:耐薬品性ビニルシート等で平滑であること 目地は溶接仕上げ ・壁:耐薬品性クロス等で平滑であること。目地は専用テープ等で貼ること。 ・暗室(2.5m×2.0m程度)を設ける。暗室では酢酸を扱う。 ・特殊空調設備:タンパク質の精製等の低温室 4°C±2°C ・特殊換気:ドラフトを通じて排気 ・ドラフトチャンバー:幅1800 湿式スクラーパー付 ・実験用ステンレス製流し ・実験排水:RI ・使用核種、数量は以下の通り。 <ul style="list-style-type: none"> P32 年間使用数量2GBq 3ヶ月使用数量 1GBq 1日最大使用数量 100MBq P33 年間使用数量3GBq 3ヶ月使用数量 1GBq 1日最大使用数量 100MBq S35 年間使用数量3GBq 3ヶ月使用数量 1GBq 1日最大使用数量 100MBq H3 年間使用数量 3GBq 3ヶ月使用数量 1.5GBq 1日最大使用数量 200MBq C14 年間使用数量 3GBq、3ヶ月使用数量 1.5GBq 1日最大使用数量 200MBq ・照明器具:アクリルカバー付 ・天井:耐薬品性クロス等で平滑であること。目地は専用テープ等で貼ること。 ・排気系には高性能フィルターを設置 ・空調温度制御は補助的に室内循環空調とし、RI給気系はオールフレッシュ分のみの温度制御とする。 ・危険物取扱所用防火区画 ・その他:酸素濃度計(液体窒素) ・エアコンのドレンはRI排水に導くこと。 ・LAN 	
d	B3	32	低温室	低温条件下での実験を行う	<ul style="list-style-type: none"> ・管理区域、P1区域 ・温度条件:特殊空調設備:タンパク質の精製等に必要(4°C±2°C)の低温を維持できる空調設備 ・床:耐薬品性ビニルシート等。・床:耐薬品性ビニルシート等で平滑であること 目地は溶接仕上げ ・壁:耐薬品性クロス、パーティション等。 ・実験用ステンレス製流し ・実験排水:RI ・使用核種と数量は以下の通り(分子標識実験室に含まれる) <ul style="list-style-type: none"> P32 年間使用数量2GBq 3ヶ月使用数量 1GBq 1日最大使用数量 100MBq P33 年間使用数量3GBq 3ヶ月使用数量 1GBq 1日最大使用数量 100MBq S35 年間使用数量3GBq 3ヶ月使用数量 1GBq 1日最大使用数量 100MBq H3 年間使用数量 3GBq 3ヶ月使用数量 1.5GBq 1日最大使用数量 200MBq C14 年間使用数量 3GBq、3ヶ月使用数量 1.5GBq 1日最大使用数量 200MBq ・危険物取扱所用防火区画 ・必ず排気を設ける。 ・エアコンのドレンはRI排水 に導くこと。 ・別表1-1に挙げた電気容量には部屋の空調に必要な電気容量を含んでいない 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
d	B3	33	細胞培養室	細胞培養実験を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・扉: H2,000mm×W850mm(片開き) ・管理区域(非密封RI) ・床: 耐薬品性ビニールシート 目地は溶接仕上げ ・壁: 耐薬品性パーティションパネル 目地はシリコンシール仕上げ ・空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 ・実験用ステンレス製流し ・実験排水: RI ・使用核種と数量は以下の通り <ul style="list-style-type: none"> P32 年間使用数量2GBq 3ヶ月使用数量 1GBq 1日最大使用数量 100MBq P33 年間使用数量3GBq 3ヶ月使用数量 1GBq 1日最大使用数量 100MBq S35 年間使用数量3GBq 3ヶ月使用数量 1GBq 1日最大使用数量 100MBq H3 年間使用数量 3GBq 3ヶ月使用数量 1.5GBq 1日最大使用数量 200MBq C14 年間使用数量 3GBq, 3ヶ月使用数量 1.5GBq 1日最大使用数量 200MBq ・照明器具: アクリルカバー付 ・天井: 耐薬品性パーティションパネル 目地はシリコンシール仕上げ ・排気系には高性能フィルターを設置 ・空調温度制御は補助的に室内循環空調とし、RI給気系はオールフレッシュ分のみの温度制御とする。 ・危険物取扱所用防火区画 ・その他: 酸素濃度計(液体窒素) ・エアコンのドレンはRI排水に導くこと。 ・クリーンベンチ, 安全キャビネット使用 ・LAN 	
d	B3	34	暗室	オートラジオグラフィー等を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・扉: H2,000mm×W850mm(片開き) ・管理区域(非密封RI)、P1区域 ・床: 耐薬品性ビニールシート等で平滑であること 目地は溶接仕上げ ・壁: 耐薬品性クロス等で平滑であること。目地は専用テープ等で貼ること。 ・天井: 耐薬品性クロス等で平滑であること。目地は専用テープ等で貼ること。 ・暗室では酢酸を扱う。 ・塩ビ製流し ・実験排水: RI ・使用核種と数量は以下の通り(分子標識実験室に含まれる) <ul style="list-style-type: none"> P32 年間使用数量2GBq 3ヶ月使用数量 1GBq 1日最大使用数量 100MBq P33 年間使用数量3GBq 3ヶ月使用数量 1GBq 1日最大使用数量 100MBq S35 年間使用数量3GBq 3ヶ月使用数量 1GBq 1日最大使用数量 100MBq H3 年間使用数量 3GBq 3ヶ月使用数量 1.5GBq 1日最大使用数量 200MBq C14 年間使用数量 3GBq, 3ヶ月使用数量 1.5GBq 1日最大使用数量 200MBq ・照明器具: アクリルカバー付 ・排気系には高性能フィルターを設置 ・空調温度制御は補助的に室内循環空調とし、RI給気系はオールフレッシュ分のみの温度制御とする。 ・危険物取扱所用防火区画 ・エアコンのドレンはRI排水に導くこと。 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
d	B3	35	生物化学実験室	<p>非密封の放射性同位元素を使用する。密封RIの使用は予定していない。主な作業としては生体分子の標識化あるいは活性測定など。実験室にはドラフトの設置が必要となる。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・非密封RI管理区域、P1区域 ・特別な遮蔽を設けなくてもRIを使用できるようにすること。その際に核種の数量を変更する場合は事前に相談すること。 ・仕様についてはRI施設としての基準を満たすこと。 ・床:耐薬品性ビニルシート等で平滑であること 目地は溶接仕上げ ・壁:耐薬品性クロス等で平滑であること。目地は専用テープ等で貼ること。 ・扉:W1,800mm(両開き) ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・実験用ステンレス製流し ・実験装置用給排水:試薬、培地調製 ・都市ガス:滅菌作業用 ・給湯設備:家庭用給湯器程度 ・実験排水:RI ・ドラフトチャンバー:幅1800 湿式スクラーパー付 ・使用核種と数量は以下の通り <ul style="list-style-type: none"> P32 年間使用数量2GBq 3ヶ月使用数量 1GBq 1日最大使用数量 100MBq P33 年間使用数量3GBq 3ヶ月使用数量 1GBq 1日最大使用数量 100MBq S35 年間使用数量3GBq 3ヶ月使用数量 1GBq 1日最大使用数量 100MBq H3 年間使用数量 3GBq 3ヶ月使用数量 1.5GBq 1日最大使用数量 200MBq C14 年間使用数量 3GBq 3ヶ月使用数量 1.5GBq 1日最大使用数量 200MBq ・照明器具:アクリルカバー付 ・天井:耐薬品性クロス等で平滑であること。目地は専用テープ等で貼ること ・排気系には高性能フィルターを設置 ・空調温度制御は補助的に室内循環空調とし、RI給気系はオールフレッシュ分のみの温度制御とする。 ・危険物取扱所用防火区画 ・その他:酸素濃度計(液体窒素) ・エアコンのドレンはRI排水に導くこと。 ・クリーンベンチ使用 ・LAN 	
d	B3	36	動物実験室	<p>マウスやラットの飼育および解剖を行い、摘出した臓器や細胞等の培養を行う。実験室は洗浄・消毒が可能な構造とし、排気口、排水口には動物の逃亡防止設備を設けること(出入口にはネズミ返し、排気口には逃亡防止 網、流し台にはメザラを付ける等)。また、外部から昆虫やげっ歯類が侵入できないようにする必要がある。万一逃亡した動物を容易に捕獲できるよう、柵等は壁などと隙間のないよう設置した上で固定し、シールすること。また万一病原菌が発生した場合などにそなえて、部屋はシール可能な構造とし、ガス消毒ができるように通気管システムが構築されていなくてはならない。</p> <p>摘出した臓器や細胞は管理区域内に持ち込み、RI標識化合物の取込実験などに供するため、管理区域への 出入口近く配置を希望する。また生化学的な処理を施し実験試料とするため、濃度分析室に隣接させ、室同士を出入りできるようにすることを希望する。</p> <p>動物の逸走防止対策や、臭気対策・消毒可能な構造とする必要などもあるため、室の設計にあたっては動物実験施設の設計経験が豊富な業者による担当を希望する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・扉:H2,000mm×W1250mm(親子開き) 扉は二重扉とし、出入口の付近に手洗い用ながしが必要。内側の扉にはネズミ返しを取り付けられるよう専用のレールのとりつけが必要。 ・下限数量以下のRI使用室 ・非管理区域の管理区域に出入りしやすい場所での設置望ましい。 ・また濃度分析室の隣りに配置されることが望ましい。 ・床:耐薬品性ビニルシート等平滑で 目地は溶接仕上げ ・壁:耐薬品性パーティション等。目地はシリコンシール仕上げ ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・特殊換気:臭気対策のため個別換気ケーシングシステム用排気、排気量2CMM程度、活性炭カートリッジ要、ガス消毒ができるように通気管システムを構築。 ・実験用ステンレス製流し、手洗い用陶器流し ・都市ガス:要(実験器具の滅菌用) ・給湯設備:家庭用給湯器程度 ・実験排水:放射線区域系(下限数量以下系)RI排水 ・ドラフトチャンバー:幅1200 乾式スクラーパー付 ・照明器具:アクリルカバー付、明暗リズムを作るためのタイマー等が必要。 ・天井:耐薬品性パーティションで平滑であること。目地はシリコンシール仕上げ。 ・危険物取扱所用防火区画 ・動物の臭気対策には十分に配慮のこと。 ・エアコンのドレンは放射線区域系(下限数量以下系)RI排水に導くこと。 ・LAN 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
d	B3	37	濃度分析室	<p>下限数量以下の使用室であり、各種物理化学実験、放射能測定などを行う。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・下限数量以下のRI使用室 ・扉: W1,800mm(両開き) ・仕上げ、間仕切り ・下限数量以下のH3,C15P32、P33,S35を使用するため、関連する法令の基準を満たすことが必要である。 ・床: 耐薬品性ビニルシート等で平滑であること 目地は溶接仕上げ ・壁: 耐薬品性クロス等で平滑であること。目地は専用テープ等で貼ること。 ・データ解析ルーム、小分析室を設ける。スライドドアで間仕切り、実験スペースの状況がデスクワークスペースからも常時観察できるように強化ガラス窓で間仕切ること。 ・ドラフトチャンバー: 幅1800 乾式スクラーパー付 ・実験用ステンレス製流し ・都市ガス: 要(実験器具の滅菌用) ・実験排水: 放射線区域系(下限数量以下系)RI排水 ・照明器具: アクリルカバー付 ・天井: 耐薬品性クロス等で平滑であること。目地は専用テープ等で貼ること。 ・危険物取扱所用防火区画 ・その他: 酸素濃度計(液体窒素) ・特殊換気として 真空ポンプ排気接続用NW-40ステンレス配管継手を部屋の2箇所の隅に設けること。 ・エアコンのドレンは放射線区域系(下限数量以下系)RI排水 に導くこと。 ・クリーンベンチ, 安全キャビネット使用 ・LAN 	
d	B3	38	生物化学試料調製室	<p>主にRI実験に必要な細胞や生体分子を調製する実験を行う。下限数量以下のRIを使用する。有機溶剤を利用した核酸抽出を行うこともあり、実験室にはドラフトの設置が必要となる。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・下限数量以下のRI使用室 ・扉: W1,800mm必要である ・仕上げ、間仕切り ・床: 耐薬品性ビニルシート等で平滑であること 目地は溶接仕上げ ・壁: 耐薬品性クロス等で平滑であること。目地は専用テープ等で貼ること ・天井: 耐薬品性クロス等で平滑であること。目地は専用テープ等で貼ること ・ドラフトチャンバー: 幅1200 湿式スクラーパー付 2基 ・実験用ステンレス製流し ・実験用給水 試薬培地調整用 ・都市ガス: 実験器具の滅菌用 ・実験排水: 放射線区域系(下限数量以下系)RI排水 ・照明器具: アクリルカバー付 ・危険物取扱所用防火区画 ・その他: 酸素濃度計(液体窒素) ・可燃ガス使用によるシリンダキャビネット2台(ドラフトに接続口)を設けること ・エアコンのドレンは放射線区域系(下限数量以下系)RI排水 に導くこと ・クリーンベンチ使用 ・LAN 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
d	B3	41	メスバウア実験室1	<p>密封57Coを含むメスバウア装置本体を設置。メスバウア効果実験室(2)と合わせて一室と考え、その一部に2×5m程度のスペースがとれればよい。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・密封RIの管理区域 ・使用する密封RIは、57Co 370MBq×4であり、廃棄物は発生しない ・扉:W850mm(片開き) ・隣接するメスバウア効果実験室(2)との間のみドアを設置し、段差を作らない。 ・鍵必要。 ・室仕様については密封RI施設としての基準を満たすこと。 ・放射線の遮蔽性を確保すること。 ・床:耐薬品性、耐動荷重ビニルシート等。 ・窓は設けない。 ・メスバウア効果実験室2との壁に配線、配管用の開口10φを3ヶ所程度設ける(遮蔽に配慮)。 ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・危険物取扱所用防火区画 ・ガンマ線遮蔽のため鉛2mm厚を壁・天井・扉にはり、さらにステンレス板等で補強 ・カードリーダーを出入口扉付近入室用、退室用の2台を設置 ・LAN 	
d	B3	42	メスバウア実験室2	<p>非管理区域。メスバウア装置の計測部分および周辺装置を設置し、実験準備・解析等を行う。メスバウア効果実験室(1)と合わせて一室と考え、(1)へは(2)からのみアクセスする。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・メスバウア効果実験室(2)は一般区域 ・扉:W1,250mm(親子開き) ・出入口扉上部に「使用中」の表示灯を設置する。 ・メスバウア効果実験室1への出入口には段差を設けないこと。 ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・実験用陶器製流し(蛇口は3つ又) ・給湯設備:電気温水器 ・特殊ガス配管:He回収(メーター設置)、液体窒素 ・危険物取扱所用防火区画 ・その他:酸素濃度計(液体窒素およびヘリウム) ・天井高4.0m ・LAN 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
d	B3	43	非密封陽電子実験室	<p>非密封の陽電子線源を用いた、陽電子消滅実験を行う。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・管理区域(非密封) ・使用する非密封RIの種類と数量は以下の通り 22Na10MBq(1日)、20MBq(3ヶ月)、20MBq(1年) 68Ge20MBq(1日)、20MBq(3ヶ月)、20MBq(1年) ・扉:W1250mm(親子開き) ・室仕様についてはRI施設としての基準を満たすこと。 ・Heの回収配管を設ける。 ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・特殊換気:ドラフトを通じて排気 ・ドラフトチャンバー:幅1200 ・実験用ステンレス製流し(実験容器洗浄・排水のため) ・実験排水:RI ・機器冷却水 ・特殊ガス配管:He回収(メーター設置) ・照明器具:アクリルカバー付 ・排気系には高性能フィルターを設置 ・空調温度制御は補助的に室内循環空調とし、RI給気系はオールフレッシュ分のみの温度制御とする。 ・床は塩ビ系長尺シートとし、巾木巻上は150mm ・壁、天井の仕上げはクリーンクロスとし、目地は専用のテープを貼ること。 ・危険物取扱所用防火区画 ・その他:酸素濃度計(液体窒素) ・エアコンのドレンはRI排水に導くこと。 ・可燃ガス使用によるシリンダキャビネット(ドラフトに接続口)を設けること。 ・LAN 	
d	B3	44	陽電子実験室	<p>密封の陽電子線源を用いた、陽電子消滅実験を行う。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・管理区域(密封RI) ・天井 2次元移動可能1tonクレーン ・クレーン:密封陽電子線源の鉛製収納容器等の1ton近い重量物の上げ下ろしや移動。 ・扉:W1,250mm(親子開き) ・室仕様については密封RI施設としての基準を満たすこと。 ・密封の陽電子線源を使用する室としての基準を満たすこと。 ・使用する密封RIの種類と個数は以下の通り。 22Na1.11GBq× 2個 68Ge185MBq× 2個 ・Heの回収配管を設ける。 ・密封線源貯蔵室(2m×2m CH2,000程度)を設ける。 ・密封線源貯蔵室は耐火構造とし所定の遮蔽性能を確保すること。 ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・換気等:排気ダクト(広域スペース) ・実験用ステンレス製流し(実験容器洗浄・排水のため) ・実験排水:一般実験 ・機器冷却水 ・特殊ガス:He回収 ・その他:酸素濃度計(液体窒素) ・カードリーダーを出入口扉付近入室用、退室用の2台を設置。 ・LAN 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
d	B3	51	ポンベ庫	ポンベの保管	<ul style="list-style-type: none"> ・ポンベの搬出入のため出来るだけ入口の段差をなくす。 ・電話 ・陶製流し ・排水:一般排水 ・LAN 	
d	B3	52	材料工学共通実験室(1)	材料工学の共通実験室として使用する。	<ul style="list-style-type: none"> ・扉:幅は(2,000)mm必要である ・分電盤2面。 ・単相200Vファクトライン用 30A (6kW) 2回路。 ・単相100Vファクトライン用 20A (2kW) 2回路。 ・単相200V実験用 50A (10kW) 1回路。 ・単相200V実験用 30A (6kW) 3回路。 ・単相100V実験用 50A (5kW) 1回路。 ・単相100V実験用 30A (3kW) 3回路。 ・単相100Vコンセント 20A (2kW) 4回路。 ・単相100V予備 20A (2kW) 2回路。 ・三相200V実験用 50A (17kW) 2回路 ・三相200V実験用 30A (10kW) 1回路。 ・床:耐薬品性ビニルシート等。床排水側溝。 ・高度空調 ・ドラフトチャンバー:幅1500 スクラバー(排ガス洗浄装置) ・実験用陶器製流し、実験用ステンレス製流し(実験器具洗浄、手洗い) ・実験装置用給排水:実験機器冷却のため必要。 ・都市ガス設備:実験機器の加熱のため必要。 ・給湯設備:家庭用湯沸器程度 電気温水器(ステンレス流しの各所) ・実験排水:一般実験 ・液体窒素利用。 ・部屋の吸気口にはクラス100000のフィルターを設置 ・天井面の配線ダクト(1φ100V20A 2回路、1φ200V30A 2回路)を設置 	

エリア(室名)	用途	特殊条件	備考
d B3 53 材料工学専攻共通 実験室(2)	材料工学の共通実験室として使用する。	<ul style="list-style-type: none"> ・扉:幅は(2,000)mm必要である ・分電盤2面。 ・単相200Vファクトライン用 30 A (6 kW) 2回路。 ・単相100Vファクトライン用 20 A (2 kW) 2回路。 ・単相200V実験用 50 A (10 kW) 1回路。 ・単相200V実験用 30 A (6 kW) 3回路。 ・単相100V実験用 50 A (5 kW) 1回路。 ・単相100V実験用 30 A (3 kW) 3回路。 ・単相100Vコンセント 20 A (2 kW) 4回路。 ・単相100V予備 20 A (2 kW) 2回路。 ・三相200V実験用 50 A (17 kW) 2回路 ・三相200V実験用 30 A (10 kW) 1回路。 ・床:耐薬品性ビニルシート等。 ・床排水側溝。 ・パーティションにて分割。 ・高度空調 ・ドラフトチャンバー:幅1800×3台 スクラバー(排ガス洗浄装置) ・実験用陶器製流し、実験用ステンレス製流し(実験器具洗浄、手洗い) ・実験装置用給排水:実験機器冷却のため必要。 ・都市ガス設備:実験機器の加熱のため必要。 ・給湯設備:家庭用湯沸器程度 電気温水器 ・実験排水:一般実験 ・特殊ガス配管:He回収(Heクライオスタット使用時のHeガス回収のため) ・液体窒素利用。 ・部屋の吸気口にはクラス100000のフィルターを設置 ・天井面の配線ダクト(1φ100V20A 2回路、1φ200V30A 2回路)を設置 	

エリア(室名)	用途	特殊条件	備考
a B2 1-1 環境熱流体工学分野、 熱材料力学分野、流体 物理学分野共同実験 室	大型風波水槽実験装置、開水路実験装置、風洞 実験装置、縦型格子乱流実験装置、横型格子乱 流実験装置、グリッドタンク等大型の流体実験装 置を用いて実験を行う。 主として、環境熱流体工学分野・熱材料力学分 野・流体物理学分野の研究室所属の教官、研究 員および大学院生が使用する。 利便性向上のため、研究室と実験室は同じ棟に あること。	1. 扉：サービস্যード側搬入扉(H4,000mm×W4,000mm両開き小扉付き)1箇所。通路(B1-1-4室と2室の間)からの出入り口は、 H2,000mm×W2,000mm。 2. 床：仕様は別表1-1の通り。防音、防水であること。1000kg/m ² 以上の耐荷重。 3. 壁：仕様は別表1-1の通り。防音であること。 4. 天井：仕様は別表1-1の通り。防音であること。 5. 照明：500ルクス以上。高さ6mのところに蛍光灯設置。点灯は6か所(2×3)で独立していること。頻繁な点灯・消灯が可能であること。 6. 採光窓：ドライエリアとサービস্যードに面した壁には天井近くに採光窓を設ける。ただし、完全遮光できる電動シャッターを設置する。 7. 実験用吸排気口：(1m×1m)(吸排気口にはすべて蓋を備える)高さ3mおよび6mに設置合計12個設置する。 8. 排気：蓋付一般換気扇を高さ3mおよび6mに取り付ける。合計10個。換気量は各5立方メートル/分(1時間で全体を換気できる量)。 9. 特殊排気：排気ダクトを別紙の図面のように3本設置し、それぞれにφ0.3mの開閉式蓋付・長さ3m程度の蛇腹付の排気口を2つずつ 設ける。排気ダクト出口には、換気ファンを設けダクト単体で排気機能(排気量は各5立方メートル/分)あり。ダクトは高さ4mに設置。 10. 空調：仕様は別紙1-1参照。恒温環境(20~30°C±2°C可変、湿度成り行き)。 11. 給水：12トン/h以上。(1-1,1-2,1-3,1-4室全体の総量) 12. 冷却水：水温は10度一定。給水23トン/h。 13. 給湯設備：水温は50度一定。給水5トン/h以上を供給できる設備を設ける。室内の各温水供給弁へ、ドライスペースに設けたガス給 湯器から供給する。 14. 実験用ステンレス製流し(2m)。部屋内に3台設置(水道、都市ガス栓、温水給湯器付)。流しの近くに、水道栓2つ、実験用大型水栓、 温水栓、冷却水栓、排水栓を各1つ備えること。 15. 給水口：流し台とは別に、床埋込型の給水口を7個設ける。実験用水道栓2つ、大型給水栓、温水栓、冷却水栓。 16. 実験排水：一般実験排水および塩水。実験装置(大水量)からの水漏れ等への対処法として、 排水溝(W×D=200×100mm)を添付の図面のように計4本設置する。排水溝内には5m間隔でφ80mmの排水口を設ける。 この場合、その先から汚臭や害虫などの実験室への侵入を防ぐための対策が必要。排水溝にはL=2m程度の蓋を設けること。 排水24トン/h以上(1-1,1-2,1-3,1-4室全体の総量)。 17. 都市ガス：30m ³ /h(25Aガス管)以上。 18. 電源：3つの親配電盤で管理され、それぞれ独立して子配電盤への配電供給系を設ける。 容量は別紙1-1の通り。精密機器へのノイズ混入防止のため、D種アース設置必要。 19. LAN：3研究室が独立してVLANを設置可能である必要がある。 情報コンセントの種類・個数および設置場所は別紙1-1および別紙の図面に示した通り。 21. クレーン：0.5t対応のチェンブロック1基。 22. 専用ガス庫：7m ³ のガスボンベ合計12個を屋外専用ガス庫に安全に設置できる必要がある。 床は出っ張りなしのフラット構造、中央ドアは180度回転する蝶番使用、室内にガスを供給するため、合計12か所のガス栓が必要。 23. 窒素・圧縮空気などを上述のボンベ庫から室内に供給できる配管を備えること。 24. 風波水槽実験装置、開水路実験装置、風洞実験装置、縦型格子乱流実験装置等は実験装置ではあるものの建物に固定し、 配管・ダクト等の接続工事が必要。	

エリア(室名)			用途	特殊条件	備考
a	B2	1-2		<p>1. 扉: サービスヤード側および共同実験室(B1-1-1)の間に親子扉(親両開扉W3000mm×H3000mm、子扉W800mm×H1800mm)を設ける。</p> <p>2. 床: 仕様は別表1-1の通り。防音、防水であること。1000kg/m²以上の耐荷重。</p> <p>3. 壁: 仕様は別表1-1の通り。防音であること。</p> <p>4. 天井: 仕様は別表1-1の通り。防音であること。高さは3m。天井の上側に、高所からの共同実験室内撮影用電源コンセントを設置。天井上部の、空調および排気用ダクト類は、壁側(サービスヤード側)に寄せて設置すること。</p> <p>5. 空調: 共同実験室(B1-1-1)とは独立していること。恒温環境(20~37°C±1°C)。送風強度および方向が可変であること。設備は天井上部(サービスヤード壁側)に設置し、その通風口は各部屋1つとする。</p> <p>6. 排気: 各部屋に独立して、大容量排気用ダクトを設ける。非使用時には、排気ダクト口を閉じられるように開閉式の蓋を設置する。排気ダクトは外壁(サービスヤード側)から各部屋へは天井の上部を通して配管し、各部屋に天井から下向きの排気ダクト口(φ0.3m程度)が出る形で設置する。排気ダクトには換気ファンを取り付ける。通常換気扇は設けない。</p> <p>7. 照明: 共同実験室(B1-1-1)とは独立していること。頻繁な点灯・消灯が可能であること。</p> <p>8. 採光窓: サービスヤード側には設けない。共同実験室(B1-1-1)との間に観察窓(1000mm×1000mm、高さ1500mmの位置)を設けるが、完全に遮光できるシャッターをつけること。</p> <p>9. 実験用ステンレス流し(W2000mm)。</p> <p>10. 給水口: 水道水、冷却水、実験用大型配水、温水の供給口が2箇所必要。1つはステンレス流しの近く、もうひとつは部屋中央部に床埋め込み式。流量は共同実験室(B1-1-1)と同じ。</p> <p>11. 実験排水: 排水口(φ80mm)は床埋め込み式で2箇所。流量などの仕様は共同実験室(B1-1-1)と同じ。</p> <p>12. 特殊ガス: 共同実験室に隣接する専用ポンペ庫から供給できる配管を備えること。供給は共同実験室(B1-1-1)とは独立であること。</p> <p>13. 電源: B1-1-2、B1-1-3、B1-1-4室の共通親配電盤はB1-1-1室内に設置。</p>	
a	B2	1-3		<p>1. 扉: サービスヤード側および共同実験室(B1-1-1)の間に親子扉(親両開扉W3000mm×H3000mm、子扉W800mm×H1800mm)を設ける。</p> <p>2. 床: 仕様は別表1-1の通り。防音、防水であること。1000kg/m²以上の耐荷重。</p> <p>3. 壁: 仕様は別表1-1の通り。防音であること。</p> <p>4. 天井: 仕様は別表1-1の通り。防音であること。高さは3m。天井の上側に、高所からの共同実験室内撮影用電源コンセントを設置。天井上部の、空調および排気用ダクト類は、壁側(サービスヤード側)に寄せて設置すること。</p> <p>5. 空調: 共同実験室(B1-1-1)とは独立していること。恒温環境(20~37°C±1°C)。送風強度および方向が可変であること。設備は天井上部(サービスヤード壁側)に設置し、その通風口は各部屋1つとする。</p> <p>6. 排気: 各部屋に独立して、大容量排気用ダクトを設ける。非使用時には、排気ダクト口を閉じられるように開閉式の蓋を設置する。排気ダクトは外壁(サービスヤード側)から各部屋へは天井の上部を通して配管し、各部屋に天井から下向きの排気ダクト口(φ0.3m程度)が出る形で設置する。排気ダクトには換気ファンを取り付ける。通常換気扇は設けない。</p> <p>7. 照明: 共同実験室(B1-1-1)とは独立していること。頻繁な点灯・消灯が可能であること。</p> <p>8. 採光窓: サービスヤード側には設けない。共同実験室(B1-1-1)との間に観察窓(1000mm×1000mm、高さ1500mmの位置)を設けるが、完全に遮光できるシャッターをつけること。</p> <p>9. 実験用ステンレス流し(W2000mm)。</p> <p>10. 給水口: 水道水、冷却水、実験用大型配水、温水の供給口が2箇所必要。1つはステンレス流しの近く、もうひとつは部屋中央部に床埋め込み式。流量は共同実験室(B1-1-1)と同じ。</p> <p>11. 実験排水: 排水口(φ80mm)は床埋め込み式で2箇所。流量などの仕様は共同実験室(B1-1-1)と同じ。</p> <p>12. 特殊ガス: 共同実験室に隣接する専用ポンペ庫から供給できる配管を備えること。供給は共同実験室(B1-1-1)とは独立であること。</p> <p>13. 電源: B1-1-2、B1-1-3、B1-1-4室の共通親配電盤はB1-1-1室内に設置。</p>	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
a	B2	1-4			<p>1. 扉: サービスヤード側および共同実験室(B1-1-1)の間に親子扉(親両開扉W3000mm×H3000mm、子扉W800mm×H1800mm)を設ける。</p> <p>2. 床: 仕様は別表1-1の通り。防音、防水であること。1000kg/m²以上の耐荷重。</p> <p>3. 壁: 仕様は別表1-1の通り。防音であること。</p> <p>4. 天井: 仕様は別表1-1の通り。防音であること。高さは3m。天井の上側に、高所からの共同実験室内撮影用電源コンセントを設置。天井上部の、空調および排気用ダクト類は、壁側(サービスヤード側)に寄せて設置すること。</p> <p>5. 空調: 共同実験室(B1-1-1)とは独立していること。恒温環境(20~37°C±1°C)。送風強度および方向が可変であること。設備は天井上部(サービスヤード壁側)に設置し、その通風口は各部屋1つとする。</p> <p>6. 排気: 各部屋に独立して、大容量排気用ダクトを設ける。非使用時には、排気ダクト口を閉じられるように開閉式の蓋を設置する。排気ダクトは外壁(サービスヤード側)から各部屋へは天井の上部を通して配管し、各部屋に天井から下向きの排気ダクト口(φ0.3m程度)が出る形で設置する。排気ダクトには換気ファンを取り付ける。通常換気扇は設けない。</p> <p>7. 照明: 共同実験室(B1-1-1)とは独立していること。頻繁な点灯・消灯が可能であること。</p> <p>8. 採光窓: サービスヤード側には設けない。共同実験室(B1-1-1)との間に観察窓(1000mm×1000mm、高さ1500mmの位置)を設けるが、完全に遮光できるシャッターをつけること。</p> <p>9. 実験用ステンレス流し(W2000mm)。</p> <p>10. 給水口: 水道水、冷却水、実験用大型配水、温水の供給口が2箇所必要。1つはステンレス流しの近く、もうひとつは部屋中央部に床埋め込み式。流量は共同実験室(B1-1-1)と同じ。</p> <p>11. 実験排水: 排水口(φ80mm)は床埋め込み式で2箇所。流量などの仕様は共同実験室(B1-1-1)と同じ。</p> <p>12. 特殊ガス: 共同実験室に隣接する専用ボンベ庫から供給できる配管を備えること。供給は共同実験室(B1-1-1)とは独立であること。</p> <p>13. 電源: B1-1-2、B1-1-3、B1-1-4室の共通親配電盤はB1-1-1室内に設置。</p>	
a	B2	2	客員実験室2	客員教員・研究者用実験室として使用する。	<ul style="list-style-type: none"> ・扉: 幅は(2,000)mm必要である ・分電盤2面。 ・単相200Vファクトライン用 30A (6kW) 2回路。 ・単相100Vファクトライン用 20A (2kW) 2回路。 ・単相200V実験用 50A (10kW) 1回路。 ・単相200V実験用 30A (6kW) 3回路。 ・単相100V実験用 50A (5kW) 1回路。 ・単相100V実験用 30A (3kW) 3回路。 ・単相100Vコンセント 20A (2kW) 4回路。 ・単相100V予備 20A (2kW) 2回路。 ・三相200V実験用 50A (17kW) 2回路 ・三相200V実験用 30A (10kW) 1回路。 ・床: 耐薬品性ビニルシート等。床排水側溝。 ・高度空調 ・ドラフトチャンバー: 幅1500 スクラバー(排ガス洗浄装置) ・実験用陶器製流し、実験用ステンレス製流し(実験器具洗浄、手洗い) ・実験装置用給排水: 実験機器冷却のため必要。 ・都市ガス設備: 実験機器の加熱のため必要。 ・給湯設備: 家庭用湯沸器程度 電気温水器(ステンレス流しの各所) ・実験排水: 一般実験 ・液体窒素利用。 ・部屋の吸気口にはクラス100000のフィルターを設置 ・天井面の配線ダクト(1φ100V20A 2回路、1φ200V30A 2回路)を設置 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
b	B2	1	ナノ物性工学実験室	<p>加速器を用いたイオンビーム分析実験、真空蒸着装置を用いた成膜実験を行う。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 冷却水:クーリングタワーで大気開放して放熱するタイプの冷却水は不可 扉:幅は(1800)mm必要である 1t対応のクレーン(天井走行式)。 計測用ケーブル・電源ケーブル取り回し用ビット。内部に排水口を設ける。 サービスヤード側搬入扉(H4,000mm×W3,000mm両開き小扉付き)1箇所。 西側通路に面した壁に扉を設ける。 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。年間を通して60%以下の湿度を保証する。 実験用ステンレス流し 給湯設備:電気温水器設置 クラス10万以下の準クリーンルーム仕様となるようなフィルター付換気装置。 特殊ガス(KrF)配管が必要 	
b	B2	2-1	光工学分野実験室A	<ul style="list-style-type: none"> レーザーを用いた光計測実験を行う。 原子、分子、固体の資料作成とその評価を行う。 各種レーザーを用いた表面界面のダイナミクスの分光研究を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> A、B、Cの間は取り外し可能なパネル壁で天井まで仕切り。 他の部屋と独立した水道。 液体窒素利用。 クレーン:1t、天井移動式、実験機器運搬のため 実験室A-B、B-C間は、一部可動間仕切りとし大物搬入に対応可能とする。 サービスヤード側扉(標準) 親子開き扉(W1,250mm×H2,100mm)(A-B間) 暗室用カーテン(完全遮光)。 床:耐薬品性ビニルシート等。 CH=直天。 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ◎温度22°C±2°C ◎湿度RH50%以下 実験用陶器製流し、実験用ステンレス製流し(実験器具洗浄、手洗い) 実験装置用給排水:実験機器冷却のため。市水は錆びるので上水系統毎バルブを入れる。循環タイプと排水タイプ。 都市ガス設備:実験用バーナー(ガラス加工、資料作成のため) 実験排水:一般実験(冷却水排水(非常時)) クレーン:1t(実験機器運搬のため) 特殊ガス配管:He回収(メーター設置) A、B、C室は独立照明回路とする。(光がもれ無いこと) 部屋の吸気口にはクラス100000のフィルターを設置。 壁面にも蛍光灯を設置。 電源のノイズ除去のためD種設置が必要。 窓無し。 中2階の設置。 中2階部分にも電源コンセントを設置(任意の場所x2にそれぞれ2口ずつ程度)。 水道の蛇口を変更。 酸素濃度警報機の設置。 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
b	B2	2-2	光工学分野実験室 B	<ul style="list-style-type: none"> ・レーザーを用いた光計測実験を行う。 ・原子、分子、固体の資料作成とその評価を行う。 ・各種レーザーを用いた表面界面のダイナミクスの分光研究を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> ・A、B、Cの間は取り外し可能なパネル壁で天井まで仕切り。 ・他の部屋と独立した水道。 ・液体窒素利用。 ・実験室A-B、B-C間は、一部可動間仕切りとし大物搬入に対応可能とする。 ・親子開き扉(W1,250mm×H2,100mm)(A-B、B-C間) ・暗室用カーテン(完全遮光)。 ・床:耐薬品性ビニルシート等。 ・天井吊フック(2kg/箇所)2箇所。 ・CH=3.5m。 ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・◎温度22°C±2°C ◎湿度RH50%以下 ・実験用陶器製流し、実験用ステンレス製流し(実験器具洗浄、手洗い) ・実験装置用給排水:実験機器冷却のため。市水は錆びるので上水系統毎バルブを入れる。循環タイプと排水タイプ。 ・都市ガス設備:実験用バーナー(ガラス加工、資料作成のため) ・実験排水:一般実験(冷却水排水(非常時)) ・特殊ガス配管:He回収(メーターは無し、配管のみ) ・A、B、C室は独立照明回路とする。(光がもれ無いこと) ・部屋の吸気口にはクラス100000のフィルターを設置。 ・電源のノイズ除去のためD種設置が必要。 ・窓無し。 ・水道の蛇口を変更。 ・酸素濃度警報機の設置。 	
b	B2	2-3	光工学分野実験室 C	<ul style="list-style-type: none"> ・レーザーを用いた光計測実験を行う。 ・原子、分子、固体の資料作成とその評価を行う。 ・各種レーザーを用いた表面界面のダイナミクスの分光研究を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> ・A、B、Cの間は取り外し可能なパネル壁で天井まで仕切り。 ・他の部屋と独立した水道。 ・液体窒素利用。 ・実験室A-B、B-C間は、一部可動間仕切りとし大物搬入に対応可能とする。 ・両開き扉(W1,800mm×H2,100mm)(廊下側)。 ・親子開き扉(W1,250mm×H2,100mm)(A-B間) ・暗室用カーテン(完全遮光)。 ・床:耐薬品性ビニルシート等。 ・天井吊フック(2kg/箇所)2箇所。 ・CH=3.5m。 ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・◎温度22°C±2°C ◎湿度RH50%以下 ・実験用陶器製流し、実験用ステンレス製流し(実験器具洗浄、手洗い) ・実験装置用給排水:実験機器冷却のため。市水は錆びるので上水系統毎バルブを入れる。循環タイプと排水タイプ。 ・都市ガス設備:実験用バーナー(ガラス加工、資料作成のため) ・実験排水:一般実験(冷却水排水(非常時)) ・特殊ガス配管:He回収(メーターは無し、配管のみ) ・A、B、C室は独立照明回路とする。(光がもれ無いこと) ・部屋の吸気口にはクラス100000のフィルターを設置。 ・電源のノイズ除去のためD種設置が必要。 ・窓無し。 ・水道の蛇口を変更。 ・酸素濃度警報機の設置。 	

エリア(室名)			用途	特殊条件	備考
b	B2	3	熱物理学分野実験室2 機械理工学専攻・物性工学講座・熱物理学分野の実験室である。 熱物理学に関する実験研究を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・コンセント(アース端子付き):すべて100V20A-E付き ・開閉器(アース端子付き):(1)~(8) 1φ3W(単相200V)50A :(9)~(16) 3φ3W(三相200V)50A ・実験盤(アース端子付き):電灯主幹(単相100V)400A以上 :電灯主幹(単相200V)400A以上 :動力主幹(三相200V)400A以上 ・その他:液体窒素使用, 窒素ガス(ポンペ)使用, アルゴンガス(ポンペ)使用, 空気ガス(ポンペ)使用, 酸素ガス(ポンペ)使用。 ・サービスヤード側搬入扉(H4,000mm×W3,000mm両開き小扉付き)1箇所 ※出入り口には採光窓をつけない。 ・床:耐薬品性ビニルシート等 ・直天 ※採光窓不要 ・空調設備:一般的に快適温度を目安とする。 ・特殊空調設備:光学実験装置の保全のため(参考室-低温室・恒温恒室・クリーンルーム)。 ◎温度 20℃±2℃ ◎湿度40%±10% ・実験用陶器製流し ・実験装置用給排水:高温実験装置の水冷のため, 15℃以下 5L/min以上 5箇所以上。 ・都市ガス設備:実験用バーナー(ろう付け, 半田付け, ガラス加工, 試料作製などのため)。 ・給湯設備:家庭用湯沸器程度(手洗い, 実験試料洗浄, 実験装置洗浄, 実験室清掃などのため)。 ・実験排水:一般実験, その他(高温実験)。 	
b	B2	4	熱物理学分野実験室1 機械理工学専攻・物性工学講座・熱物理学分野の実験室である。 熱物理学に関する実験研究を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・廊下側扉:W1,700mm(親開き)1箇所 ※出入り口には採光窓をつけない。 ・コンセント(アース端子付き):すべて100V20A-E付き ・開閉器(アース端子付き):(1)~(5) 1φ3W(単相200V)50A :(6)~(10) 3φ3W(三相200V)50A ・実験盤(アース端子付き):電灯主幹(単相100V)200A以上 :電灯主幹(単相200V)200A以上 :動力主幹(三相200V)200A以上 ・その他:液体窒素使用, 窒素ガス(ポンペ)使用, アルゴンガス(ポンペ)使用, 空気ガス(ポンペ)使用。 ・床:耐薬品性ビニルシート等 ・直天 ※採光窓不要 ・空調設備:一般的に快適温度を目安とする。 ・特殊空調設備:光学実験装置の保全のため(参考室-低温室・恒温恒室・クリーンルーム)。 ◎温度 20℃±2℃ ◎湿度40%±10% ・実験用陶器製流し ・実験装置用給排水:高温実験装置の水冷のため, 15℃以下 5L/min以上 2箇所以上 ・都市ガス設備:実験用バーナー(ろう付け, 半田付け, ガラス加工, 試料作製などのため)。 ・給湯設備:家庭用湯沸器程度(手洗い, 実験試料洗浄, 実験装置洗浄, 実験室清掃などのため)。 ・実験排水:一般実験, その他(高温実験)。 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
b	B2	5	熱工学分野実験室	熱工学、伝熱工学に関する実験を行なう。 ガス(主に空気、酸素、炭化水素燃料、水素)や液体(主に水)を用いる。 燃焼実験や燃料電池による発電実験を行なうので、ガス供給・排気設備が必要である。	<ul style="list-style-type: none"> ・扉:幅は(1,800)mm必要である。 ・壁・天井に吸音対策(グラスウールマット等)。 ・床:耐薬品性ビニルシート等。 ・サービスヤード側搬入扉(H4,000mm×W3,000mm両開き小扉付き)1箇所。 ・空調設備:一般的に快適温度を目安とする。 ・実験用陶器製流し ・実験装置用給排水:高温実験装置の水冷のため。15°C以下、5L/min以上、2箇所。 ・都市ガス設備:ガスバーナー使用のため必要。 ・給湯設備:家庭用湯沸器程度(手洗い、実験試料洗浄、実験装置洗浄、実験室清掃などのため)。 ・実験排水:一般実験、その他(高温実験) ・ガスセンサと連動する特設排気設備(標準排気と別系統) ・サービスヤードからポンペの出し入れができるガス供給用ポンペ室。(2m×3m程度の面積) 	
b	B2	6	電気室			
b	B2	7	機械室			

エリア(室名)	用途	特殊条件	備考
b B2 8 医療工学分野実験室	<p>実験室として使用 組織培養、蛍光観察、摩擦特性評価、遺伝子測定などを行う 中二階あり 大型ドラフトチャンバー 臭気発生の可能性(屋上ダクトに防臭装置が必要) 一部バイオクリーン環境(クラス10,000, エアシャワーなし)において、組織・細胞・分子の調整・実験、組換え遺伝子実験(P1レベル)を行う。 また、組換え遺伝子実験を行うため、拡散防止措置(物理的封じ込め)P1レベルを設置。 小動物の短期間の飼育・実験を実施する。その臭気発生を防ぐため、汚水・高度換気。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・扉: W1,250mm(親子開き) ・外部からの振動を極力おさえる。 ・空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。インバータータイプで24時間換気、熱交換可能タイプ。 ・特殊換気: 屋上ダクトファン設置(臭気対策有り) ・ドラフトチャンバー: 幅1800 (脱臭装置付き, 流し機能は必須)2台 ・実験用ステンレス製流し(実験器具の洗浄など) ・実験装置用給排水: 実験排水、汚水(一般排水)、薬液は原液回収、ドレーは蓋付 ・都市ガス設備: クリーンベンチ用バーナー ・給湯設備: 家庭用湯沸器程度 電気温水器 ・実験排水: 解剖, 汚水排水 ・特殊ガス配管: He回収(回収バックがあり、その一定留めた後に回収) ・(停電対策必要) ・緊急用床排水口 ・防水床 ・ネットワーク(KUINS-II,III)および電話 ・床: 耐薬品性ビニルシート等。 ・採光窓。・酸欠防止用センサー サービスマン側搬入扉(H4,000mm×W3,000mm両開き小扉付き)1箇所。 クレーンは手動簡易型(固定だが移動可能) ・実験盤2カ所 ・拡散防止措置(物理的封じ込め)P1レベルを設置のため簡易(可動)パーティションにて暗室を分割。 ・給湯設備: 家庭用湯沸器程度 電気温水器(ステンレス流しの各所) ・液体窒素利用。 ・部屋の吸気口にはクラス100000のフィルターを設置 ・天井面の配線ダクト(1φ100V20A 2回路、1φ200V30A 2回路)を設置 	

エリア(室名)	用途	特殊条件	備考
b B2 9-1 バイオメカニクス実験室1	<p>バイオクリーン環境において、組織・細胞・分子の調整・実験、組換え遺伝子実験(P1レベル)、蛍光顕微鏡観察等を実施する実験室。</p> <p>無菌的なクリーン環境において、マイクロ、サブマイクロメートルの生体組織・細胞等の構造と機能の関係を実験的に解析・評価する。</p> <p>生体分子、遺伝子、細胞、生体組織を用いた微細かつ無菌の実験を行うため、室温・湿度の制御、クリーンルーム(クラス10,000,エアシャワーなし)環境が不可欠。</p> <p>組換え遺伝子実験を行うため、拡散防止措置(物理的封じ込め)P1レベルを設置。</p> <p>汚染を防ぐため、室内を与圧し、換気(吸入)口には、HEPAフィルターを設置。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・壁コンセントは、実験机上部取り付けH900mm ・蛍光顕微鏡により細胞観察行う簡易暗室空間を作る。 ・恒温恒湿室: 温度23°C±2.0, 湿度50%以下 ・クリーンルーム内与圧+HEPAフィルタ(class10000) ・屋上ダクトファン(ドラフトチャンバー) ・実験用ステンレス流し(ドラフトチャンバー1、実験流し台3、給湯器3は、事業者にご用意していただく。) ・実験装置用給排水 ・緊急用床排水口 ・低温室(持ち込み設置、室外機有り) ・都市ガス ・家庭用湯沸かし器程度の給等設備 ・出入り口: H2,100mm・W1,250(親子開き: 廊下側) ・防水床 ・ネットワーク(KUINS-II,III)および電話 ・遮光カーテン(一部の簡易暗室領域、天井まで)。 ・サービスヤード側搬入扉(H4,000mm×W3,000mm両開き小扉付き)1箇所。 ・床: 耐薬品性ビニルシート等。 ・天井4.0m ・採光窓。 ・空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 ・特殊空調設備: バイオマテリアル、生体組織・細胞の特性は、温度・湿度に敏感であるため、一定湿度・温度に保つことの出来る空調を必要とする。インバータータイプで容量に余裕のあるものを必要とする。24時間換気、熱交換可能タイプとする。(参考室-クリーンルーム) ・◎温度23°C±2°C ◎湿度50%(120%負荷を見る) ・特殊換気: 屋上ダクトファン設置(陽圧に設定)実験室9-2とは、独立ダクトとする。 ・スクラパー(排ガス洗浄装置) ・実験用ステンレス製流し(実験容器洗浄・排水のため) ・実験装置用給排水: 器具洗浄機、蒸留水製造装置、観察装置等の冷却。23度(常温)100L/min ・都市ガス設備: クリーンベンチ内でバーナー利用(試料調整に加熱・滅菌を必要とするため) ・給湯設備: 家庭用湯沸かし器程度(作業に伴う手や衣服の汚れを落とすため)90°C供給。 ・実験排水 ・独立照明。(一部簡易暗室設置のため) 	

エリア(室名)	用途	特殊条件	備考
b B2 9-2 バイオメカニクス実験室2	<p>バイオクリーン環境において、組織・細胞・分子の調整・実験、組換え遺伝子実験(P1レベル)、蛍光顕微鏡観察等を実施する実験室。また、一時的な動物組織を用いた実験・観察を実施。</p> <p>無菌的なクリーン環境において、マイクロ、サブマイクロメートルの生体組織・細胞等の構造と機能の関係を実験的に解析・評価する。</p> <p>生体分子、遺伝子、細胞、生体組織を用いた微細かつ無菌の実験を行うため、室温・湿度の制御、クリーンルーム(クラス10,000, エアシャワーなし)環境が不可欠。</p> <p>また、組換え遺伝子実験を行うため、拡散防止措置(物理的封じ込め)P1レベルを設置。</p> <p>汚染拡散を防ぐため、クリーンルーム内を与圧等圧調節し、換気口(吸入側)にはHEPAフィルタを、および、換気口(排出側)には、脱臭装置を設置。</p> <p>9-1室とは独立照明。</p> <p>動物試料使用のため、汚水・高度換気。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・壁コンセントは、実験机上部取り付けH900mm ・恒温恒湿室: 温度23°C±2.0°C, 湿度50%以下 ・クリーンルーム内 等圧+HEPAフィルタ(class10000) ・屋上ダクトファン(ドラフトチャンバー) ・実験用ステンレス流し ・実験用ステンレス流し(ドラフトチャンバー1、実験流し台1、給湯器1は、事業者にご用意していただく。) ・実験装置用給排水 ・緊急用床排水口 ・動物試料を用いた実験(換気、汚水) ・都市ガス ・家庭用湯沸かし器程度の給等設備 ・出入り口:H22,100mm・W1,250(親子開き:廊下側) ・防水床 ・ネットワーク(KUINS-II,III)および電話 ・サービスヤード側搬入扉(H4,000mm×W3,000mm両開き小扉付き)1箇所。 ・床:耐薬品性ビニルシート等。 ・天井4.0m ・採光窓。 ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・特殊空調設備:バイオマテリアル、生体組織・細胞の特性は、温度・湿度に敏感であるため、一定湿度・温度に保つことの出来る空調を必要とする。インバータータイプで容量に余裕のあるものを必要とする。24時間換気、熱交換可能タイプとする。(参考室-クリーンルーム+動物試料実験) ・◎温度23°C±2°C ◎湿度50%(120%負荷を見る) ・特殊換気:屋上ダクトファン設置(等圧用に給気必要)実験室9-1とは、独立ダクトとする。 ・スクラバー(排ガス洗浄装置) ・実験用ステンレス製流し(実験容器洗浄・排水のため) ・実験装置用給排水:器具洗浄機、蒸留水製造装置、観察装置等の冷却。23度(常温)100L/min ・都市ガス設備:クリーンベンチ内でバーナー利用(試料調整に加熱・滅菌を必要とするため) ・給湯設備:家庭用湯沸器程度(作業に伴う手や衣服の汚れを落とすため)90°C供給。 ・実験排水:汚水排水 ・独立照明。 ・動物試料を用いた実験を行うため、汚水・高度換気。 	
b B2 10 レンタル		<ul style="list-style-type: none"> ・床:耐薬品性ビニルシート等。 ・床排水側溝。 ・高度空調 ・実験用ステンレス製流し(実験器具洗浄、手洗い) ・実験装置用給排水:実験機器冷却のため必要。 ・都市ガス設備:実験機器の加熱のため必要。 ・給湯設備:家庭用湯沸器程度 電気温水器 ・実験排水:一般実験 ・特殊ガス配管:He回収(Heクライオスタット使用時のHeガス回収のため) ・液体窒素利用。 ・部屋の吸気口にはクラス100000のフィルターを設置 ・天井面の配線ダクト(1φ100V20A 2回路、1φ200V30A 2回路)を設置 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
b	B2	11	化学処理室2	機械系共通実験室として、酸、アルカリ、および有機溶媒などを用いた薬品処理試料の前処理、後処理などを実施するために用いられる。	<ul style="list-style-type: none"> ・ガス(窒素)、圧縮空気供給配管 ・イオン交換水は各ドラフトへ配管 ・超純水は各ドラフトへ配管 ・酸欠防止用センサー ・室温:18~25degCの範囲で±2degCに、また湿度60%以下に制御可能な空調 ・クリーン10万相当、結露しないこと、外から塵埃が入らないこと。 ・排気ダクト ・電子錠仕様(・入退室が管理できるシステム) ・液体窒素は建物で共通であればよい(室外) ・内部監視用カメラ(前室で管理できるように) ・給湯設備:家庭用湯沸器・電気温水器) ・ドラフトチャンバー スクラバー有り ・酸・アルカリドラフトは作業面が落とし込み槽のものがよい、標準仕様品でカスタマイズ可能であれば標準仕様品でもOKです。 ・酸・アルカリ、有機用ドラフトいずれもドラフトを2台設置するため、ドラフト2台+横置き(スクラバ、活性炭ユニット)のほうが上置き一体型ドラフト2台よりも設置コストが安いのではという判断です。統一したほうがよい(安い)ならばそれでもOK。 	
b	B2	12-1	材料系共通実験室1	<p>固体力学分野、適応材料力学分野、材料物性学分野がそれぞれの分野の特徴(接着・環境、複合材料(ミクロ、メゾ、マクロ)、ナノ材料)を活かした共同研究を実施するための共通実験室である。試験片作製及び強度評価実験を実施する。試験片作製のためのプレス装置及び真空装置、試験片の切断・研磨のためのファインカッター、マイクロカッター、研磨機を設置する。さらに試験片表面化学処理用のドラフトチャンバを設置する。サーボパルサーの設置場所に関しては、床振動の影響を排除するために独立基礎とする。また、温度等の環境試験のための試験機一式(精密万能試験機等)を設置する。ナノ・マイクロ試験片の作製、実験実施、観察装置のために、恒温室を設ける。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・恒温室はCH=4.0m、壁:防塵塗装。 ・床:耐薬品性ビニルシート等。 ・サービスヤード側搬入扉(H4,000mm×W3,000mm両開き小扉付き)1箇所。 ・壁・天井に吸音対策(グラスウールマット等)。 ・一部、防震床。 ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。(夏期20℃、冬期20℃) ・特殊換気:清浄度を確保すること。 ・実験用ステンレス製流し ・ドラフトチャンバ 湿式スクラバー付き ・実験装置用給排水:走査型電子顕微鏡、試験装置、ドラフトチャンバー等に給排水を行うため。 ・都市ガス設備:将来対応用 試料調整に加熱及び湯沸しを必要とするため ・給湯設備:家庭用湯沸器程度 ・実験排水:一般実験(洗浄用で酸・有機系有り) ※温度のふらつきは、実験発熱機器が運転していないときに抑える必要有り。 ・排気:局所排気(逆流防止措置を行う) ・内部では、観察・測定に支障のない電磁場レベルが必要であり、空間・電源電圧ノイズを低減する必要がある。 すべての実験室は独立空調・独立照明仕様とする。 実験室1と実験室2の間には扉(廊下出入口の標準仕様と同じもの)を設置する。また、その扉の窓には遮光カーテンorブラインドを設置する。 	

エリア(室名)			用途	特殊条件	備考
b	B2	12-2 材料系共通実験室2	<p>固体力学分野、適応材料力学分野、材料物性学分野がそれぞれの分野の特徴(接着・環境、複合材料(マイクロ、メゾ、マクロ)、ナノ材料)を活かした共同研究を実施するための共通実験室である。試験片作製及び強度評価実験を実施する。試験片作製のためのプレス装置及び真空装置、試験片の切断・研磨のためのファインカッター、マイクロカッター、研磨機を設置する。さらに試験片表面化学処理用のドラフトチャンバを設置する。サーボパルサーの設置場所に関しては、床振動の影響を排除するために独立基礎とする。また、温度等の環境試験のための試験機一式(精密万能試験機等)を設置する。ナノ・マイクロ試験片の作製、実験実施、観察装置のために、恒温室を設ける。</p>	<p>・恒温室はCH=4.0m、壁:防塵塗装。 ・床:耐薬品性ビニルシート等。 ・サービスマード側搬入扉(H4,000mm×W3,000mm両開き小扉付き)1箇所。 ・採光窓不要。 ・壁・天井に吸音対策(グラスウールマット等)。 ・一部、防震床。 ・壁は防磁仕様。 ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。(夏期20℃、冬期20℃) ・特殊空調設備:恒温室に設置するナノ・マイクロレベルの試験片作製装置、実験装置は湿度・温度の変化に敏感であり、精密な温度管理を必要とする。空調はON-OFFタイプではなくインバータータイプのものがひつようである。 ・恒温恒湿室(温度24.5℃±0.5℃、湿度50%±10%以下 定常的な環境とする) ・特殊換気:清浄度を確保すること。 ・実験用ステンレス製流し ・ドラフトチャンバ 湿式スクラパー付き ・実験装置用給排水:走査型電子顕微鏡、試験装置、ドラフトチャンバー等に給排水を行うため。 ・都市ガス設備:将来対応用 試料調整に加熱及び湯沸しを必要とするため ・給湯設備:家庭用湯沸器程度 ・実験排水:一般実験(洗浄用で酸・有機系有り) ※温度のふらつきは、実験発熱機器が運転していないときに抑える必要有り。 ・排気:局所排気(逆流防止措置を行う) ・内部では、観察・測定に支障のない電磁場レベルが必要であり、空間・電源電圧ノイズを低減する必要がある。 すべての実験室は独立空調・独立照明仕様とする。 実験室1と実験室2の間には扉(廊下出入口の標準仕様と同じもの)を設置する。また、その扉の窓には遮光カーテンorブラインドを設置する。 ・廊下側扉には電子錠とする。</p>	
b	B2	13-1 材料物性学分野実験室1	<p>透過型電子顕微鏡、原子間力顕微鏡に組み込んだ微小負荷試験装置を用いて微小材料の強度評価実験を行う。試験片作製も同室にて行う。顕微鏡の設置場所については、床振動の影響を排除するために独立基礎とする。</p>	<p>・床:耐薬品性ビニルシート等。 ・壁・天井に防塵塗装。 ・扉に窓を設置。 ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。(夏期20℃、冬期20℃) ・特殊空調設備:主として一般的な材料実験を行う部屋であるが、一年を通じて確実に常温(20℃)に設定が可能である必要がある。恒温設備を必要としないが、確実に常温に設定できるだけの空調設備の能力の余裕が必要である。 ・特殊換気:清浄度を確保すること。 ・実験用ステンレス製流し ・実験装置用給排水:走査型電子顕微鏡、試験装置等に給排水を行うため。 ・都市ガス設備:将来対応用 試料調整に加熱及び湯沸しを必要とするため ・給湯設備:家庭用湯沸器程度 ・実験排水:一般実験(洗浄用で酸・有機系有り) ※温度のふらつきは、実験発熱機器が運転していないときに抑える必要有り。 ・排気:局所排気(逆流防止措置を行う) ・実験室1と実験室2の間には扉(廊下側出入口の標準仕様のもの)を設置する。また、その扉の窓には遮光カーテンorブラインドを設置する。 実験室2と実験室3の間には扉(廊下側出入口のRDO仕様のもの)を設置する。</p>	

エリア(室名)			用途	特殊条件	備考
b	B2	13-2 材料物性学分野実験室2	透過型電子顕微鏡、原子間力顕微鏡に組み込んだ微小負荷試験装置を用いて微小材料の強度評価実験を行う。 試験片作製も同室にて行う。顕微鏡の設置場所については、床振動の影響を排除するために独立基礎とする。	<ul style="list-style-type: none"> 床:耐薬品性ビニルシート等。 壁・天井に防塵塗装。 窓不要。 扉に窓を設置。 空調設備:夏期18℃、冬期24℃(20℃&余裕能力) 特殊空調設備:恒温室に設置するナノ・マイクロレベルの試験片作製装置、実験装置は湿度・温度の変化に敏感であり、精密な温度管理を必要とする。空調はON-OFFタイプではなくインバータータイプのものがひつようである。 恒温恒湿室(温度24.5℃±0.5℃、湿度50%±10%以下 定常的な環境とする) 実験用ステンレス製流し(材料試験用試験片の作製・研磨・洗浄などに使用) 実験装置用給排水:研磨装置、吸湿TMA(定温定湿維持装置)のための排水装置が必要 都市ガス設備:試験片作製時の加熱目的(実験用バーナー) 実験排水:一般実験 電源コンセント及び情報コンセント取付高さはFL+900mmとする。 壁は防磁仕様とする。 実験室1と実験室2の間には扉(廊下側出入り口の標準仕様のもの)を設置する。また、その扉の窓には遮光カーテンorブラインドを設置する。 実験室2と実験室3の間には扉(廊下側出入り口のRDO仕様のもの)を設置する。 	
b	B2	13-3 材料物性学分野実験室3	透過型電子顕微鏡、原子間力顕微鏡に組み込んだ微小負荷試験装置を用いて微小材料の強度評価実験を行う。 試験片作製も同室にて行う。顕微鏡の設置場所については、床振動の影響を排除するために独立基礎とする。	<ul style="list-style-type: none"> 床:耐薬品性ビニルシート等。 壁・天井に防塵塗装。 窓不要。 空調設備:夏期18℃、冬期24℃(20℃&余裕能力) 特殊空調設備:主として一般的な材料実験を行う部屋であるが、一年を通じて確実に常温(20℃)に設定が可能である必要がある。恒温設備を必要としないが、確実に常温に設定できるだけの空調設備の能力の余裕が必要である。 実験装置用給排水:研磨装置、吸湿TMA(定温定湿維持装置)のための排水装置が必要 都市ガス設備:試験片作製時の加熱目的(実験用バーナー) 実験排水:一般実験 電源コンセント及び情報コンセント取付高さはFL+900mmとする。 実験室1と実験室2の間には扉(廊下側出入り口の標準仕様のもの)を設置する。また、その扉の窓には遮光カーテンorブラインドを設置する。 実験室2と実験室3の間には扉(廊下側出入り口のRDO仕様のもの)を設置する。 	

エリア(室名)	用途	特殊条件	備考
b B2 14 適応材料力学分野 実験室B	<p>マイクロ、サブマイクロメートルの生体組織・細胞等のバイオマテリアルの構造と機能の関係を実験的に解析・評価する。</p> <p>生体材料、高分子材料を用いた微細かつ無菌的実験を行うため、室温・湿度の制御はもとより、クリーンルームとしての環境が不可欠である。</p> <p>部屋の半分に実験架台を設け、その下に細胞培養実験を行うクリーンルーム(クラス10,000, エアシャワーなし)と、上に細胞準備室を設置する。したがって、階高の高い空間が必要となる。</p> <p>クリーンルームは、細胞培養のための光を当てる部屋と、蛍光を利用した細胞内部の構造解析を行う簡易暗室(顕微鏡周りの空間を遮蔽カーテン等でブロックする程度)の2室に区分する。</p>	<p>・壁コンセントは、実験机上部取り付けH900mm</p> <p>・蛍光顕微鏡により細胞観察を行う簡易暗室空間を作る。</p> <p>・クリーンルーム内与圧+HEPAフィルタ</p> <p>・実験用ステンレス流し(DALTON NA22AS相当)</p> <p>・実験装置用給排水</p> <p>・緊急用床排水口(蓋付き, 床と面一)</p> <p>・都市ガス</p> <p>・家庭用沸湯かし器程度の給等設備</p> <p>・出入り口(クリーンルーム廊下側): H2,100mm・W1,800mm(両開き)、採光無し、高遮音性</p> <p>・出入り口(暗室廊下側): H2,100mm・W1,800mm(両開き)、採光無し、高遮音性</p> <p>・出入り口(暗室/クリーンルーム間): H2,100mm・W800mm(片開き)、採光無し、高遮音性</p> <p>・防水床</p> <p>・空調はインバータタイプで容量に余裕のあるもの、ON-OFFタイプ不可</p> <p>・騒音吸収壁、防塵壁、窓不要</p> <p>・耐荷床1000kg/m²</p> <p>・制振床床振動2μm(1~5Hz)以下</p> <p>・防水床(冷却水漏れ対策のため)</p> <p>・特殊空調設備: バイオマテリアルは温度・湿度変化に敏感で、一定温度・一定湿度に保てる空調を必要とする。特にon-offタイプは不可、インバータタイプで容量に余裕のあるもの、独立空調を必要とする。培養装置等は終日運転を行うため、24時間空調を必要とする。換気は熱交換換気可能タイプを必要とする。吸気口にHEPAフィルターを設置、クリーンルーム内は与圧(120%)。</p> <p>・◎温度20℃から25℃までの任意の温度を設定でき、通年で設定温度±0.5℃ ◎湿度50%以下 与圧(E17のクリーンルーム仕様にE19の高度空調)</p> <p>・壁コンセントは実験机上部に取付(H=900)</p> <p>・クリーンルームと暗室は独立照明。</p> <p>・微弱信号の計測の妨げとなる電源ノイズを抑えるため、アースはそれぞれに独立していること、電源自体もノイズを含まないこと、また、外部からの空間電磁ノイズを遮蔽するための壁や天井の仕様を必要とする</p> <p>・顕微鏡用レーザーの冷却に冷却水を必要とする。</p> <p>・クリーニングタワー 23℃(常温) 100L/min 4箇所</p> <p>マイクロ・サブマイクロスケール対象物の実験遂行の妨げとなる床振動を抑えるため、制振床を必要とする。</p> <p>実験室Aの装置を共用するため、両室内間を相互に移動可能であることを要する。</p> <p>但し、汚染や騒音防止のため、実験室間を防音間仕切りし、独立空調・独立照明とする。</p> <p>他に電話・ネットワーク(KUINS-II,III)を必要とする。</p>	

エリア(室名)	用途	特殊条件	備考
b B2 15-1 適応材料力学分野 実験室A-1	<p>構造材料からマイクロ材料まで長期信頼性評価に関する実験を行う。</p> <p>油圧式サーボ試験機等の疲労試験に必要な装置を設置する。表面観察のためデジタルマイクロスコープや実体顕微鏡を設置する。</p> <p>超伝導材料の電圧測定は数十nVオーダーあり、また微小荷重試験等も実施するため、測定中の僅かなノイズ(温度変化、振動、音響、電磁波、電源電圧変動)でも測定・計測精度に大きく影響を及ぼす。そのため、本実験室ではこれらノイズを極限まで排除できる仕様を必要とする。</p> <p>油圧ポンプは、防音間仕切り及び独立床よる分室に設置する。</p> <p>効率的な実験データの収集のため現有の実験架台(高さ3.2m)を改造移設する。</p> <p>純度の高い冷却水(油圧源、電気炉冷却用)、大型試験機設置のため高い天井を必要とする。</p> <p>超伝導材料冷却用に液体窒素を使用するため、安全管理上、酸素濃度警報器の設置、液体窒素供給装置に用いる加圧窒素ガスボンベの転倒防止のため、固定用設備を必要とする。</p> <p>また、室外ボンベ置き場を必要とする。</p> <p>実験室Bで実験したバイオマテリアルの評価に実験室Aの装置を共用するため、両室内間を相互に移動可能な仕様とする。</p>	<p>壁コンセントは、実験机上部取り付けH900mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現有の架台を改造移設する。 ・耐荷床1000kg/m² ・制振床床振動2μm(1~5Hz)以下 ・防水床(冷却水漏れ対策のため)・騒音吸収壁・窓不要 ・実験室Bとの出入り口H2,100mm・W1,800mm(両開き)、高遮音性、電子錠、扉に安全確認用の窓を設置 ・実験用ステンレス流し(ダルトンNA-22AS相当) ・実験装置用給排水 ・緊急用床排水口(蓋付き、床と面一) ・都市ガス ・家庭用湯沸かし器程度の給等設備 ・恒温恒湿室: 温度20℃から25℃までの任意の温度を設定でき、通年で設定温度±0.5℃、湿度50%以下(E17のクリーンルーム仕様にてE19の高度空調) ・空調はインバータタイプで容量に余裕のあるもの、ON-OFFタイプ不可 ・換気吸気口にクラス100,000のフィルター ・酸素濃度警報器の設置 ・油圧室は防音間仕切り、独立床 ・油圧室の温度上昇を防ぐための換気設備 ・床: 耐薬品性ビニルシート等。 ・壁・天井に吸音対策(グラスウールマット等)。 ・特殊空調設備: 実験材料の特性や計測は温度・湿度変化に敏感で、一定湿度・温度に保つことのできる空調を必要とする。特にon-offタイプは不可で、インバータタイプで容量に余裕のあるものを必要とする。試験装置は終日運転を行うため、24時間空調を必要とし、換気は熱交換換気可能タイプを必要とする。吸気口にクラス100,000のフィルターを設置。 ・微弱信号の計測の妨げとなる電源ノイズを抑えるため、アースはそれぞれに独立していること。電源自体もノイズを含まないこと。 また、外部からの空間電磁ノイズを遮蔽するための壁や天井の仕様を必要とする ・実験用ステンレス製流し(試料洗浄のため) ・実験装置用給排水: 器具洗浄機、蒸留水製造装置、観察装置等冷却等に給排水を行うため。 ・クリーニングタワー 23℃(常温) 100L/min 4箇所 ・都市ガス設備: 滅菌用バーナー(試料調整に加熱及び湯沸しを必要とするため)。 ・給湯設備: 家庭用湯沸器程度、電気温水器(作業による手や衣服の汚れを落とすため)。 ・実験排水: 一般排水 ・その他設備: 緊急排水口(床に設置) ・壁コンセントは実験机上部に取付(H=900) ・照明は簡易暗室空間を作るように点滅区分を分ける。 ・汚染や騒音防止のため、実験室間を防音間仕切りし、実験室A、Bおよび架台の1階、2階は、それぞれに独立空調・独立照明とする。 ・他に電話・ネットワーク(KUINS-II,III)を必要とする。 	

エリア(室名)	用途	特殊条件	備考
b B2 15-2 適応材料力学分野 実験室A-2	<p>構造材料からマイクロ材料まで長期信頼性評価に関する実験を行う。</p> <p>油圧式サーボ試験機等の疲労試験に必要な装置を設置する。表面観察のためデジタルマイクロスコープや実体顕微鏡を設置する。</p> <p>超伝導材料の電圧測定は数十nVオーダーあり、また微小荷重試験等も実施するため、測定中の僅かなノイズ(温度変化、振動、音響、電磁波、電源電圧変動)でも測定・計測精度に大きく影響を及ぼす。そのため、本実験室ではこれらノイズを極限まで排除できる仕様を必要とする。</p> <p>油圧ポンプは、防音間仕切り及び独立床よる分室に設置する。</p> <p>効率的な実験データの収集のため現有の実験架台(高さ3.2m)を改造移設する。</p> <p>純度の高い冷却水(油圧源、電気炉冷却用)、大型試験機設置のため高い天井を必要とする。</p> <p>超伝導材料冷却用に液体窒素を使用するため、安全管理上、酸素濃度警報器の設置、液体窒素供給装置に用いる加圧窒素ガスポンベの転倒防止のため、固定用設備を必要とする。</p> <p>また、室外ボンベ置き場を必要とする。</p> <p>実験室Bで実験したバイオマテリアルの評価に実験室Aの装置を共用するため、両室内間を相互に移動可能な仕様とする。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・壁コンセントは、実験机上部取り付けH900mm ・耐荷床1000kg/m² ・制振床床振動2μm(1~5Hz)以下 ・防水床(冷却水漏れ対策のため) ・騒音吸収壁 ・窓不要 ・実験装置用給排水 ・緊急用床排水口(蓋付き、床と面一) ・恒温恒湿室: 温度20℃から25℃までの任意の温度を設定でき、通年で設定温度\pm0.5℃、湿度50%以下 (E17のクリーンルームの仕様にE19の高度空調。 ・空調はインバータタイプで容量に余裕のあるもの、ON-OFFタイプ不可。 ・換気吸気口にクラス100、000のフィルター。 ・酸素濃度警報器の設置 ・微弱信号の計測の妨げとなる電源ノイズを抑えるため、アースはそれぞれに独立していること、電源自体もノイズを含まないこと。また、外部からの空間電磁ノイズを遮蔽するための壁や天井の仕様を必要とする。 ・油圧室(油圧源を設置するための別室)は防音間仕切り、独立床、天井高3m、床面積3.5m\times2m。 ・油圧室から油圧ホースをサーボ試験機に接続するための貫通孔を床ϕ100mmで12箇所設ける。 ・出入り口(油圧室): H2,100mm\cdotW1,800mm(両開き扉)採光無し、高遮音性。 ・油圧室の温度上昇を防ぐための換気設備。 ・床: 耐薬品性ビニルシート等。 ・壁・天井に吸音対策(グラスウールマット等)。 ・サービスヤード側搬入扉(H4,000mm\timesW3,000mm両開き小扉付き)1箇所(大型装置搬出入のため)、外部から粉塵等が入らないよう部屋の気密性、遮音・遮光性を損なわない扉仕様。 ・汚染や騒音防止のため、実験室間を防音間仕切りし、実験室A、Bおよび架台の1階、2階は、それぞれに独立空調・独立照明とする。 ・他に電話・ネットワーク(KUINS-II,III)を必要とする。 	

エリア(室名)		用途	特殊条件	備考	
b	B2 16-1	固体力学分野精密測定室	<p>材料の変形や破壊挙動に関するナノスケールでの精密実験・観察を実施する。 この部屋では、測定中の僅かなノイズ(温度変化、振動、音響、電磁波、電源電圧変動)の影響を強く受ける原子間力顕微鏡や微小加重疲労試験器などを用いる。 以下に示す仕様で、試験室条件を高レベルに制御するために、外壁・天井はコンクリート製とし、部屋の高さを3mに制限する。 また、隣接する実験室からの振動を排除するために防振浮床構造とする。 部屋は地階に配置され、周囲からの振動や音響を極限まで低減させる対策が施されており、温度・湿度が一定に保たれている必要がある。 また、電源電圧ノイズや電磁波の影響も受けるため、それらに対する対策が施されている必要がある。 また、粉塵からサンプルを保護するために吸排気口には粉塵予防のフィルターを設置する必要がある。 避難経路確保のために出入り口は二カ所に設ける。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・扉: H2,000mm×W850mm(片開き)・W1,250mm(親子開き) ・電源コンセントは床から900mmの位置に設置 ・材料の変形や破壊挙動に関するナノスケールでの精密実験・観察を実施する。この部屋で、測定中の僅かなノイズ(温度変化、振動、音響、電磁波、電源電圧変動)の影響を強く受ける原子間力顕微鏡や微小加重疲労試験器などを用いる。以下の仕様で、試験室条件を高レベルに制御するために外壁・天井裏はコンクリート製とし、部屋の高さを3mに制限する。 ・防振条件: 隣接する実験室からの振動を排除するために防振浮床構造とする。 ・温度・湿度条件: 恒温恒湿(on,offタイプではなくインバータタイプで温度20℃±1℃、湿度50%±10%を維持できること)、壁面や天井などに恒温・恒湿に適した材料を用いる。 ・遮音・吸音条件: 壁は完全防音壁、天井は防音室仕様、壁・天井内面に吸音材貼り付け(グラスウール50mm相当以上の吸音性) ・電磁波条件: 低電磁波レベル ・防塵性: 吸排気口にクラス100,000のフィルター設置。 ・その他: 耐荷重(1000kg/m²)、低電源電圧ノイズ、出入り口は窓なしの高遮音性。 ・入り口に段差なし(段差が発生する場合はスロープを設置)・防犯対策・電子錠、酸素濃度警報機、廊下にポスター展示用レール。 ・実験と計算を高度に融合するために、並列計算機にすぐにアクセスできる端末と情報コンセントを設置。 ・上部の周囲に手すりを設置。 ・CH=3.0m。 ・観察窓(W2.0m×H1.2m程度、防音・断熱、遮音・遮光カーテン設置)。 ・給排水の配管引き込み。 	
b	B2 16-2	固体力学分野実験室	<p>材料の変形や電子デバイスの信頼性試験などを行う。 材料試験は温度条件に敏感であるため、年間を通じて常温に室温を設定できる空調能力が必要である。 測定においては、振動等を嫌うため地階にあることが望ましい。 大型装置の搬入のために、サービスヤード側に標準の両開き扉をもうける。 この部屋で準備した試験片等を精密測定室に持ち込んで測定することも多いため、精密測定室との間に出入り口が必要である。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・サービスヤード側搬入扉標準の物(H4,000mm×W3,000mm両開き小扉付き)1箇所、腰窓(W2,000mm×H1,500mm程度で引き違い開閉のできるもの)1箇所。ハイサイド窓(採光のための固定のもの) ・ポスター展示用レール。 ・空調設備: ±2℃で温度制御のできる能力を有する物、湿度はなりゆき。 ・実験用ステンレス製流し(試験器具の洗浄、手洗い等のため) ・実験装置用給排水: 冷却水循環装置の使用のため必要。10℃ 5l/min ・給湯設備: 家庭用湯沸器程度(実験での温水使用のため) ・実験排水: あり 	

エリア(室名)		用途	特殊条件	備考		
b	B2	17	機械機能要素工学分野実験室	<p>3次元測定器、レーザー測長器等を使用し、精密機械部品の超精密ナノ・マイクロ形状測定を行う。ロボット機器などの実験を行う。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・通路側の扉は、H2,000mm、幅は(1,700)mm必要である。 ・サービスヤード側の扉は、H5,000mm、幅は(5,000)mm必要である。雨水の侵入がないようにする。 ・分電盤は3分野独立のものとする。 ・空調は3分野独立のものとする。 ・操作盤・吹き出し口など3分野独立とする。 ・通路側扉は3分野独立とする。 ・流しは3分野独立とする。実験用陶器製流し ・給湯設備: 家庭用湯沸器 ・150mm×150mmのビット有り(SUS上蓋付)(参考図面1pに図示)。電気線、圧縮空気ホースを通す。 ・天井照明は電動昇降式及び側壁より蛍光灯照明(参考図面4pに図示) ・排水口 ・床: 耐薬品性ビニルシート等。 ・独立基礎(3000mm×3000mm×H1000mm)3箇所(参考図面2ページ目に図示)。 ・建物構造体が耐えるサイズのレール吊り下げ方式の移動クレーン(1t~2t)・(b-B2-17.18.19通しで設置)。(参考図面7ページに図示) ・取り付け取り外し可能なパーティションを設置して18と仕切る。 ・移動可の高さ2m程度のものをb-B2-18との境界に設置。 ・床の振動は0.01ミクロン以下となる必要がある。 ・壁は断熱材を使用する。 ・エアフィルタ等で塵をある程度取り除く。 ・入退室管理のため電子錠とする。 ・電源については参考図面5ページ目に図示している。単相1760A・三相200V500A。 ・換気: 換気扇用躯体開口(参考図面5pに図示)→ 低騒音型産業用有圧換気扇 できれば、3室ともデリバントファンによる空調調整。 ・各換気扇独立スイッチ(スイッチは実験用分電盤内)。 ・換気用の天井扇(参考図面3pに図示) ・照明点滅区分は細分化する。 	
b	B2	18	振動工学分野実験室	<p>機械力学の振動、音響実験に使用する。加振機を使用するため、独立基礎は必須。また音響実験を行うため、他実験室からの騒音の影響を低減できる簡易半無響室が必須である。機械機能要素工学分野実験室と精密計測加工工学分野実験室と当室の3実験室共通とし、パーティションで仕切る。音響実験を行うため、音速を一定に管理する必要性から空調設備が必要である。簡易半無響室仕様 壁と床の遮音等級D50、壁と天井は吸音構造とし500Hz以上で吸音率0.8以上</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・加振機、実験定盤は独立基礎(3箇所)とする ・ノイズ低減のため個別にアース端子を設ける ・天井の照明は電動式で下まで下がること ・扉: W1,250mm(親子開き) ・床: 耐薬品性ビニルシート等。 ・サービスヤード側搬入扉(H4,000mm×W3,000mm両開き小扉付き)1箇所。 ・0.5t対応のチェーンブロック(17.18.19通しで設置)。 ・H3,000mmのパーティションで18と仕切る。独立基礎3箇所。 ・簡易半無響室(4000×4000×H3000)あり(ALC壁・天井、グラスウールt100) ・空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 ・実験用ステンレス製流し ・実験装置用給排水: 水を用いた波や脈波の実験を行う。給水は水道で可。排水溝は必要。 ・給湯設備: 電気温水器設置(実験装置の洗浄など) ・実験排水: 一般実験 ・照明器具は電動昇降式とする。 	

エリア(室名)			用途	特殊条件	備考	
b	B2	19	精密計測加工分野実験室	<p>・工作機械・産業用機械を使用し、計測・制御・加工を行う研究を行う実験室。</p>	<p>・建物構造体が耐えるサイズのレール吊り下げ方式の移動クレーン(1t~2t)・(b-B2-17.18.19通しで設置)。(参考図面7ページに図示)</p> <p>・電源(開閉器)は3相200V・150Aが1つ、3相200V・100Aが2つ(参考図面5pに図示)。残りは3相200V・50A。単相100V50A1つ。ノーフューズブレーカ、ランプつき、接地つき。高さ1500mmに設置。主幹3相200V200A→100A*2, 主幹200A→150A, 主幹200A→50A*4。</p> <p>・150mm×150mmのビット有り(SUS上蓋付)(参考図面1pに図示)</p> <p>・天井照明は電動昇降式及び側壁より蛍光灯照明(参考図面4pに図示)</p> <p>・パーティションはb-B1-17.18と同様のもの。移動可の高さ2m程度のものをb-B2-18との境界に設置。</p> <p>・床は三和研磨のスーパーフロア希望(b-B2-17.18.19通しで)(必要あれば見積もり取得可)。</p> <p>・機械搬入のためサービスヤード側搬入扉(H4,000mm×W4,000mm)を希望。建物構造上難しければ、東側に搬入扉作ること可能か?その場合、南側扉は標準扉で可。搬入扉は電動シャッター、シャッター内側に断熱材(あるいはダブルシャッター)。</p> <p>・独立基礎(3.0×3.0×H1.0)3箇所。(参考図面2pに図示)</p> <p>・空調設備:夏期23℃、冬期23℃(±2~3℃ S:50%、W:40%)</p> <p>・空調能力(40%×3台)、空調機は天吊り形EHP</p> <p>・換気:換気扇用躯体開口(参考図面5pに図示)→低騒音型産業用有圧換気扇 できれば、3室ともデリバントファンによる空調調整。各換気扇独立スイッチ(スイッチは実験用分電盤内)。</p> <p>・換気用の天井扇(参考図面3pに図示)</p> <p>・実験用ステンレス製流し(手洗い)</p> <p>・給湯設備:家庭用湯沸器程度 電気温水器</p> <p>・照明点滅区分は細分化する。</p> <p>・コンプレッサをサービスヤードに外部設置。20PS 200kg。物置のような囲いの中に設置(給排気ダクト窓必要)。隣の実験室に迷惑のかからない除振・防音・吸排気を考えた設置が必要。</p> <p>・コンプレッサから部屋内にループ型エア配管を設置(参考図面4pに図示)。必要なら見積もり取得可。</p> <p>・外部からの大型機器搬入に対し、フラットな(段差のない)床面が必要(サービスヤードより転がして搬入可能)。</p>	
c	B2	1	先端イメージング工学分野研究室	<p>・床:耐薬品性ビニルシート等。</p> <p>・暗室用カーテン。</p> <p>・サービスヤード側搬入扉(H4,000mm×W3,000mm両開き小扉付き)1箇所。</p>		
c	B2	2	機械室			

エリア(室名)	用途	特殊条件	備考
c B2 3-1 機械系共通クリーンルーム1	機械系共通実験室として、成膜、フォトリソグラフィ、エッチング、パッケージングなどの微細加工を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・扉：幅は(2,000)mm必要である ・機械系共通実験室として、c-B1-3-2とあわせて成膜、フォトリソグラフィ、エッチング、パッケージングなどの微細加工を行う。 ・各種ユーティリティ(純水、ガス、圧縮空気)はクリーンルーム機械室から供給される。 ・フォトリソグラフィのためイエロールーム ・酸欠防止用センサー ・冷却水、排水用ドレーン設置 ・クリーン1万相当、結露しないこと。 ・排気ダクト ・液体窒素は建物で共通であればよい(室外) ・入退室が管理できるシステムを設置する。 ・ピットをつくり、配管、配線等を通せるようにする。 ・純水、市水、冷却水、真空、配管など ・(21)超純水製造装置から(13)に配管。循環純水は13、14に配管。 ・配管ピット、水漏れセンサー。 ・廊下側に窓設置。 ・3-2との壁に窓設置。 ・特殊空調：クリーンルーム(イエロールーム)クラス10000 ・換気：真空ポンプ排気など・ドラフトチャンバー(幅1500)・スクラバー(排ガス洗浄装置) ・実験装置用給排水：冷却水、スクラバ、純水(各種装置の冷却・常温時5L/min以下) ・実験排水：一般実験 ・特殊ガス：He回収 ・部屋の換気：クリーンルームが陽圧であること。なお空気の流れがイエロールームから通常のクリーンルーム、廊下へとなる。 特にイエロールームのドラフトチャンバーを使用した際にも逆流が起こらないこと。 またドラフトチャンバー不使用の際にも外気が逆流しないこと。 ・クリーンルームの運転は、通常モード、省エネモード、夜間、の3種類程度に切り替えが可能とし、前室で運転を制御する。 ・内部監視用カメラ(c-B2-3-1～6に各室1、2台設置し、前室c-B2-3-6でモニタ可能とする) ・インターホン(c-B2-3-1～6相互間で通話可能にする) ・ドラフトチャンバー スクラバー有り ・酸・アルカリドラフトは作業面が落とし込み槽のものがよい、標準仕様品でカスタマイズ可能であれば標準仕様品でもOKです。 ・有機用ドラフトを2台設置するため、ドラフト2台+横置き活性炭ユニットのほうが上置き一体型ドラフト2台よりも設置コストが安いのではという判断です。統一したほうがよい(安い)ならばそれでもOK。 	

エリア(室名)	用途	特殊条件	備考
c B2 3-2 機械系共通クリーンルーム2	<p>機械系共通実験室として、成膜、フォトリソグラフィ、エッチング、パッケージングなどの微細加工を行う。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・扉：幅は(2,000)mm必要である ・機械系共通実験室として、c-B1-3-1とあわせ成膜、フォトリソグラフィ、エッチング、パッケージングなどの微細加工を行う。 ・各種ユーティリティ(純水、ガス、圧縮空気)はクリーンルーム機械室から供給される。 ・成膜、加工装置スペース ・制振床振動$2\mu\text{m}$(1~5Hz)以下 ・室温：18~25degCの範囲で$\pm 2\text{degC}$に、また湿度60%以下に制御可能な空調 ・酸欠防止用センサー ・冷却水、排水用ドレーン設置 ・クリーン1万相当、結露しないこと。 ・排気ダクト ・液体窒素は建物で共通であればよい(室外) ・前室からの入り口にエアシャワーとパスBOXを設置する。 ・入退室が管理できるシステムを設置する。 ・ピットをつくり、配管、配線等を通せるようにする。 ・純水、市水、冷却水、真空、配管など ・床：耐薬品性ビニルシート等。 ・配管ピット、水漏れセンサー。 ・廊下側に窓設置。 ・B1-6、B1-3-1との壁に窓設置。 ・換気：真空ポンプ排気など・ドラフトチャンバー(幅1500)・スクラバー(排ガス洗浄装置) ・実験用陶器製流し ・実験装置用給排水：冷却水、スクラバ、純水(各種装置の冷却・常温時5L/min以下) ・実験排水：一般実験 ・部屋の換気：クリーンルームが陽圧であること。なお空気の流れがイエロールームから通常のクリーンルーム、廊下へとなる。 ・特にイエロールームのドラフトチャンバーを使用した際にも逆流が起こらないこと。 ・またドラフトチャンバー不使用の際にも外気が逆流しないこと。 ・クリーンルームの運転は、通常モード、省エネモード、夜間、の3種類程度に切り替えが可能とし、前室で運転を制御する。 ・内部監視用カメラ(c-B2-3-1~6に各室1、2台設置し、前室c-B2-3-6でモニタ可能とする) ・インターホン(c-B2-3-1~6相互間で通話可能にする) 	

エリア(室名)			用途	特殊条件	備考	
c	B2	4	クリーンルーム機械室	<p>機械系共通実験室の、化学実験室、クリーンルームの機械室、装置搬入前室として使用する。ユーティリティの供給を担うために用いられる。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 扉:幅は(2,000)mm必要である 機械系共通実験室の化学実験室、クリーンルームの前室として、空調機械室として、および、ユーティリティの供給を担うために用いられる。 ポンペ、コンプレッサ、純水製造装置、などユーティリティ設備を収納するスペースを設置 空調機械を設置する部屋と装置搬入室、ポンペ庫の3つに分かれる。 空調機械室は直天、その他は天井有 装置搬入のためのスペース 酸欠防止用センサー 電子錠仕様(・入退室が管理できるシステム) 実験流し ガスポンペ室のガスは顕微鏡室、化学処理室、クリーンルームにも供給可能とする。 液体窒素は建物で共通であればよい(室外) クリーンルームへの入り口にエアシャワーとバスBOXを設置する。 内部監視用カメラ(c-B2-3-1~6に各室1、2台設置し、前室c-B2-3-6でモニタ可能とする) インターホン(c-B2-3-1~6相互間で通話可能にする) 屋外に液体窒素供給設備、窒素ガス製造装置を設置。 ガス、N2、Ar、O2など(共通配管と相互に関係) 純水は化学処理室、クリーンルーム内を循環させる。配置に基づいて出口を設置する 真空ポンプは化学処理室、クリーンルーム内を配管しておく。使用機器には接続点をつくる。Vac表示。 空調:一般的な快適温度を目安とする。(装置搬入室) 	
c	B2	5	化学処理室1	<p>機械系共通実験室として、酸、アルカリ、および有機溶媒などを用いた薬品処理、さらには試料の前処理、後処理などを実施するために用いられる。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 扉:W1,250mm(親子開き) ガス(窒素)、圧縮空気供給配管 各種ユーティリティ(純水、ガス、圧縮空気)はクリーンルーム前室から供給される。 室外ポンペ置き場 酸欠防止用センサー 冷却水、排水用ドレーン設置 都市ガス 室温:18~25degCの範囲で±2degCに、また湿度60%以下に制御可能な空調 クリーンルーム(class100,000相当)、結露しないこと、外から塵埃が入らないこと。 排気ダクト 電子錠仕様(・入退室が管理できるシステム) 遮光カーテン(開閉可能)(一部を暗室として使用可能なように区切ることができるようにする) 液体窒素は建物で共通であればよい(室外) 内部監視用カメラ(前室で管理できるように) ⑦超純水製造装置から⑦両ドラフトに配管 機械室からの純水配管は①、⑦、⑧へ 内部監視用カメラ(c-B2-3-1~6に各室1、2台設置し、前室c-B2-3-6でモニタ可能とする) インターホン(c-B2-3-1~6相互間で通話可能にする) 床:耐薬品性ビニルシート等。 サービスヤード側に扉設置(W2,000mm×H2,500mm程度)。 換気:ドラフトチャンバー(幅1500)・スクラバー(排ガス洗浄装置) 実験用ステンレス製流し 実験装置用給排水:排水溝を設ける(各種装置の冷却・常温時5L/min以下、配置図に記載) 都市ガス:実験用 給湯設備:家庭用湯沸器・電気温水器) 実験排水:一般実験 ドラフトチャンバー スクラバー有り 酸・アルカリドラフトは作業面が落とし込み槽のものがよい、標準仕様品でカスタマイズ可能であれば標準仕様品でもOKです。 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
c	B2	6	クリーンルーム前室	機械系共通実験室として、化学実験室、クリーンルームの前室として着替え待機するためのスペース。 クリーンルーム、化学処理室の監視を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 扉: H2,000mm × W850mm(片開き) クリーンルーム、顕微鏡室、化学処理の前室として着替え、また待機できるスペース 女子更衣室を設置する。 酸欠防止用センサー 電子錠仕様(入退室が管理できるシステム) 一般流し(湯沸かし器付き) 液体窒素は建物で共通であればよい(室外) クリーンルームへの入り口にエアシャワーとバスBOXを設置する。 内部監視用カメラ(c-B2-3-1~6)に各室1、2台設置し、前室c-B2-3-6でモニタ可能とする、一括監視、記録システムを本室に設置する。入退室管理システムと連携させる。1週間程度のモニタ画像保存可能とする。外部からのリモート監視機能。 インターホン(c-B2-3-1~6相互間で通話可能にする) B1-3-2との間の壁に窓設置。 空調: 一般的な快適温度を目安とする。 ミニキッチン 	
c	B2	7-1	構造材料強度分野実験室	構造材料・構造部材に対する変形・強度特性実験および複合材料の試験片成形、材料の熱処理、顕微鏡組織観察などを行う。 精密計測室では、温度・湿度を高度に制御し、振動を抑制した環境のもとで、材料特性や材料損傷・欠陥に対する超音波計測および超音波画像化システムによる内部診断等の研究を行う。(プレハブ等でも可) また、適宜、精密計測室に設置した超音波計測機器を持ちだして、変形試験中の超音波計測等を行う。 さらに、計算機により材料・構造物の動的特性に関するシミュレーション等を行う。	<ul style="list-style-type: none"> クレーン: 1.5tおよび0.5t、万能試験機等重量機器設置のため 扉: 幅は(2,500)mm、高さは2,500mm必要 実験室内に、精密計測室を設置(プレハブ等でも可)。 万能試験機設置のため、コンクリート基礎を形成する必要あり(1,900mm × 2,050mm)。(別紙参照) 床: 耐薬品性ビニルシート等。 1.5t及び0.5t対応のクレーン(天井走行式)各1基。 サービスタイド側搬入扉(H4,000mm × W3,000mm両開き小扉付き)2箇所。 採光窓要。 空調: 一般的な快適温度を目安とする。 換気: シリンダーキャビネット排気(緊急排気) ・ドラフトチャンバー(幅1200)・スクラパー(排ガス洗浄装置) 実験用陶器製流し 実験装置用給排水: 排水溝を設ける(各種装置の冷却・常温時5L/min以下、配置図に記載) 都市ガス: ガラス加工のためのガスバーナー使用。 給湯設備: 家庭用湯沸器・電気温水器) 実験排水: 一般実験(原液)一次処理は実験室側処理、洗浄排水は実験排水として処理(PH調整して処理) 特殊ガス: O₂、液体CO₂N₂、Ar、圧縮空気(中央供給方式になれば供給を受けたい) 防音仕様とする。 	
c	B2	7-2	構造材料強度分野精密計測室	温度・湿度を高度に制御し、振動を抑制した環境のもとで、材料特性や材料損傷・欠陥に対する超音波計測および超音波画像化システムによる内部診断等の研究を行う。	<ul style="list-style-type: none"> CH=3.0m。 特殊空調: 温度に敏感に依存する材料特性に対する精密超音波測定を行うため、室内温度・湿度を制御出来ること。 温度25°C ± 1°C、湿度50% ± 1% 精密計測室は、外部の振動・電磁ノイズをある程度遮蔽できる壁・床・天井とする。 床: 耐薬品性ビニルシート等。 実験用陶器製流し 実験装置用排水口を設ける(実験装置付近、配置図に記載) 防音室仕様とする。 精密計測室から実験室(7-1)への出口は段差をなくすこと(高低差がある場合はスロープ)。 	

エリア(室名)			用途	特殊条件	備考	
c	B2	8-1	航空宇宙力学実験室(1)	<p>航空宇宙工学における力学・制御実験とともに、コンピュータによる数値シミュレーションを行うために関連の各種装置を設置する。 利用者は、教職員と学生や共同研究の研究者などであり、実験によっては、長時間の計測時間を要する。 研究目的に応じ、実験室の中にフレーム・パネル等の工法により実験室(2)と(3)を設ける。 実験室全体を指すことになるが、他の部分を実験室(1)と呼ぶ。 建設後数年を目処に回流型風洞を挿入することを念頭に部屋の仕様を策定している。 回流型風洞は、模型を測定部に入れ、飛行力学と制御、空力特性実験や煙による流れの可視化を行う装置である。 最大風速35m/sで、運転時には100dB程度の騒音を発生する。 回流型風洞の総重量は50トン以上と見込まれる。</p>	<p>・研究目的に応じ実験室の中にフレーム・パネル等の工法により実験室(2)と(3)を設ける。他の部分(実験室全体を指す)を実験室(1)と呼ぶ。後述の天井走行クレーンと干渉しない範囲で、実験室(2)と(3)の天井はできるだけ高くする。下記の風洞導入に備え、実験室(2)と(3)を個別に解体可能なように施工する。 ・導入予定の回流型風洞は、密閉式測定胴および開放式測定胴が装着可能で、最大高さ2.1m×幅2.1m×長さ2.5m以上、最大風速35m/sで、電動機電力75kW、総重量は45トン、運転時には100dB程度の騒音を発生すると見込まれる。(様詳細未定) ・床面は、総重量45トンの風洞が設置(固定)できる十分な強度(1.5ton/m²、床厚300mm)を有し、送風機部の重量基礎(深さ1,000mm)を後工事で可能とし、滑らない防水床、床面排水用ドレイン、静電気対策、装置固定アンカー可であること。 ・運転時に発生する騒音と振動が外部に洩れないよう、床、壁、天井に防音を施す。また、冷暖房費に配慮して断熱壁とする。 ・大型機材搬入のためサービスヤードに面した壁に、可能な限り大型の両開き扉を設け、その断熱にも配慮する。 ・装置の分解・移動のために、2.9ton天井面走クレーンを備える。左右壁天井付近にレールを装着し、実験室(2)と(3)の上を含む、実験室(1)全体を移動可能にする。なお、導入予定の風洞は、このクレーンで設置可能である。 ・電源に必要な3層200V600+300A、単層200V200A、単層100V400Aが配電され、配電盤の手元開閉器で開閉できること。装置に応じ第1種アース配線、無停電電源・ノイズ対策を施す。 ・風洞の電動機が最大75kWを消費する状態で、実験室単独で標準設計温度に空調可能とする。1回/時間程度の全体換気のために熱交換器付換気ダクト等を設置する。また、実験室(2)と(3)は独立空調とし、室内機器が10kWを消費する状態でE20(乾球温度20～30℃±2℃、相対湿度40～70%±10%)の高度空調を可能にする。 ・上水道、流し台、電気瞬間湯沸し器、ガス、発熱機器のために冷却水を用いた冷却を可能にする。元圧10気圧程度の圧縮空気、可能なら真空供給系を備える。 ・実験室(1)全体は通常照度の照明に加え、2倍の照度にはできる。実験室(1)内の実験室(2)と(3)の上とそれ以外の部分で照明を独立にする。 床水平面平均照度 1000 lx、均斉度 0.5 以上、照度の時間的変化がないこと。そのために、例えばランプ交換(メンテナンス)しやすい長寿命のメタルハライドランプ(500W程度)等を使用すること。窓から自然光を取り込むこと。 また、電動式暗幕等で完全に遮光できること。実験室(2)と(3)の天井には、実験室(1)とは独立に通常の照度の照明を設置する。 ランプ交換が容易なこと。 ・廊下等からの配線配管アクセスのための配線配管用ラダー。 ・必要に応じて、警告灯(緊急時、実験時)用パネル。 ・扉:廊下側:W2,000mm×H3,000mmは必要である。 ・2.9t対応のクレーン(天井走行式)1基。 ・床:耐薬品性ビニルシート等。・床面の指定箇所に単層100Vコンセント。 ・サービスヤード側搬入扉:可能な限りW3,600mm×H6,000mmに近づけ、両開き小扉付き)1箇所。 ・防音仕様。 ・実験室(1)と(3)、(2)と(3)の間は防音サッシによる観察窓設置。 ・遮光用カーテン設置。 ・壁・天井に吸音対策(グラスウールマット等)。 ・採光窓要。 ・空調:実験室(1)は一般的な快適温度を目安とする。実験室(2)と(3)は独立空調とし、室内機器が10kWを消費する状態でE20(乾球温度20～30℃±2℃、相対湿度40～70%±10%)の高度空調を可能にする。 ・実験用ステンレス製流し2台。 ・実験装置用給排水:排水溝を設ける(各種装置の冷却・常温時5L/min以下、配置図に記載) ・都市ガス:ガラス加工のためのガスバーナー使用。 ・給湯設備:電気温水器 ・実験排水:一般実験</p>	
c	B2	8-2	航空宇宙力学実験室(2)	<p>・空調:実験室(2)と(3)は独立空調とし、室内機器が10kWを消費する状態でE20(乾球温度20～30℃±2℃、相対湿度40～70%±10%)の高度空調を可能にする。 ※他は実験室(1)にまとめて記載</p>		

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
c	B2	8-3	航空宇宙力学実験室(3)		<ul style="list-style-type: none"> 空調:実験室(2)と(3)は独立空調とし、室内機器が10kWを消費する状態でE20(乾球温度20~30°C±2°C、相対湿度40~70%±10%)の高度空調を可能にする。 洗面台 ※他は実験室(1)にまとめて記載 	
c	B2	9	機械室			
c	B2	10	顕微鏡室	<p>機械系共通実験室として、種々の材料、微小構造物の表面や破断面をナノメートルオーダーの分解能で性状の観察や元素分析などを実施するために用いられる。</p> <p>電子顕微鏡等の有する高分解能(1.5nm)での観察を高精度に安定して行うためには、下記に列挙する条件を満たすように振動や磁気変動をできるだけ低減する必要がある。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 別表2記載の①、②、④、⑦の機器はそれぞれでカーテンで囲うことができるようにする。また、それぞれに対応する照明は手元でON/OFFができるようにリモコンあるいはスイッチが設置されること。 2Eとしたコンセントはそれぞれ機器占有として、それぞれが個別の回路となるようにする。 制振床 床振動2μm(1~5Hz)以下 エレベータ(移動磁性体)近辺ではなく10m以上離れること 磁気シールド 浮遊磁界 商用周波数0.2μT(2mG)以下 不規則変動0.1μT(1mG)以下 以上の仕様が満足されれば磁気シールド不要 酸欠防止用センサー 電子錠仕様 遮光カーテン(開閉可能) 装置間に遮光カーテンにて分離可能なこと 冷却水(純度の高いものに限る) 1L/min 50~100Pa × 5ヶ所 照明は電磁シールドリモコンでON、OFFでき調光装置つき クリーン10万相当結露しないこと、外から塵埃が入らないこと。 排気ダクト 窓はペアガラスにて高遮音性 実験用流し(湯沸かし器付き) 装置動作用、ダスト除去用に窒素配管 液体窒素は建物で共通であればよい(室外) 扉: W1,250mm(親子開き) 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。温度がふらつかず湿度60%以下 実験用ステンレス製流し 実験装置用給排水: 装置冷却のため。 室内をドライな環境にしたい。 冷却水 10~20°C 21L/min 水質と温度 1L/min × 100kPa × 5ヶ所 給湯設備: 家庭用湯沸器程度 電気温水器 実験排水: 一般実験 特殊ガス配管: N2 照明器具は電磁シールド、調光型とする。 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
c	B2	11	ナノマイクロシステム工学分野実験室	MEMSデバイス製作のために、酸・アルカリ・有機溶剤を用いた化学処理(洗浄・エッチング)、薄膜形成、熱処理、デバイスの組み立て、各種観察および機械的・電氣的・光学的な精密計測を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 扉：廊下側W1,250mm(親子開き)、サービスヤード側W2,000mm(両開き) ・サービスヤード側扉の上側に採光窓設置 ・空調：一般的な快適温度を目安とする。 ・特殊空調：クリーンルーム(HPEAフィルタ取り付け程度) ・換気：シリンダキャビネット排気(緊急排気)・ドラフトチャンバー(幅1200)・スクラパー(排ガス洗浄装置)・排気ダクト(天井に設置,真空ポンプと接続して排気) ・ドラフトチャンバに100V20A×2の電源を設置 ・ドラフトチャンバ：酸・アルカリ用(フッ化水素酸含む)、湿式スクラバ付き、上置き型、作業面は落とし込み槽 ・実験用ステンレス製流し ・実験装置用給排水：排水溝を設ける(各種装置の冷却・常温時5L/min以下、配置図に記載) ・都市ガス：ガラス加工のためのガスバーナー使用 ・給湯設備：家庭用湯沸器・電気温水器) ・実験排水：一般実験(原液)一次処理は実験室側処理、洗浄排水は実験排水として処理 ・特殊ガス：実験室内でO₂、液体CO₂、N₂、Arを使用。圧縮空気 ・O₂、N₂、Ar、圧縮空気については中央供給方式になれば供給を受けたい ・暗室は単独スイッチとする(暗室スペース2ヶ所にそれぞれ1つずつ設置)。 	
c	B2	12	ナノメトリックス工学分野実験室	<p>実験室として使用 主な実験内容は以下の通り</p> <p>真空プロセス、薄膜作製、微細加工 生物実験、培養、遺伝子組み換え実験 レーザ計測、X線分析、その他測定・計測 酸・アルカリ・有機溶液の取り扱い</p>	<ul style="list-style-type: none"> 扉：H2,000mm×W850mm(片開き)・W1,250mm(親子開き) ・クレーン：～3t、大型収納棚への搬入・搬出。 ・実験室中央部に大型収納棚設置(高さ～2.5m) ・単相100Vファクトライン 5箇所 ・シリンダキャビネットより特殊ガス供給 ・N₂、O₂、Ar、CO₂、Air ・SUS1/4"配管5系統：高さ約2mの箇所に設置 ・循環冷却水：8箇所 ・各配電盤からアースをA種、B種、C種、D種それぞれをとれるようにする。 ・暗室(遮光カーテンと表示、4.5mW*3.5mD*2.5mH)内は独立照明。 ・暗室外はなるべく細分化照明。 ・都市ガス：クリーンベンチ内で細胞培養時の滅菌操作のためガスバーナー使用。 ・有機ドラフトチャンバ(1.5mW)、酸・アルカリドラフトチャンバ(1.5mW)、スクラバ必要。チャンパ内部に100V15Ax2電源必要。 ・給湯設備 ・袖付きステンレスシンク(1.2mW*0.75mD*0.85mH、袖部0.4mW) ・ドラフト、シンクの排水は一般実験排水 	
c	B2	13	レンタル		<ul style="list-style-type: none"> ・床：耐薬品性ビニルシート等。 ・床排水側溝。 ・高度空調 ・実験用ステンレス製流し(実験器具洗浄、手洗い) ・実験装置用給排水：実験機器冷却のため必要。 ・都市ガス設備：実験機器の加熱のため必要。 ・給湯設備：家庭用湯沸器程度 電気温水器 ・実験排水：一般実験 ・パーティションにて分割。 ・特殊ガス配管：He回収(Heクライオスタット使用時のHeガス回収のため) ・液体窒素利用。 ・部屋の吸気口にはクラス100000のフィルターを設置 ・天井面の配線ダクト(1φ100V20A 2回路、1φ200V30A 2回路)を設置 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
c	B2	14	マイクロ加工システム分野実験室		<ul style="list-style-type: none"> 扉: 廊下側W1,250mm(親子開き)、サービスヤード側W2,000mm(両開き) 空調: 一般的な快適温度を目安とする。 換気: シリンダーキャビネット排気(緊急排気)・ドラフトチャンバー(幅1200)・スクラバー(排ガス洗浄装置)・排気ダクト(天井に設置, 真空ポンプと接続して排気) ドラフトチャンバーに100V20A×2の電源を設置 実験用ステンレス製流し 実験装置用給排水: 排水溝を設ける(各種装置の冷却・常温時5L/min以下、配置図に記載) 都市ガス: ガラス加工のためのガスバーナー使用 給湯設備: 家庭用湯沸器・電気温水器 実験排水: 一般実験(原液)一次処理は実験室側処理、洗浄排水は実験排水として処理 特殊ガス: 実験室内でO₂、液体CO₂、N₂、Arを使用。圧縮空気 O₂、N₂、Ar、圧縮空気については中央供給方式になれば供給を受けたい 	
c	B2	15	推進工学分野実験室	宇宙工学にかかわるプラズマ、および流体科学に関する実験を実施する。 なお、宇宙環境工学、宇宙マイクロナノ工学にかかわり、腐食性ガス(Cl ₂ 、HCl、BCl ₃ 、HBr、IF ₅ 、SF ₆ CF ₄ 、C ₄ F ₈ 、C ₅ F ₈ 、など)、および腐食性薬液(フッ酸など)を使用する。また、大強度レーザー、大電流、大強度電磁波、真空、クリーン環境設備があるため、安全設備には十分な対策が必要がある。	<ul style="list-style-type: none"> 扉: 両開き扉 W1,800×H2,400 [標準仕様] 2箇所 サービスヤード側搬入扉(H4,000mm×W3,000mm両開き小扉付き)[標準仕様] 1箇所 床: 耐薬品性ビニルシート等。直天井。 採光窓不要。 遮光カーテン(完全)。 防音仕様。 床面排水用ドレイン。 精密計測ボックス領域: 静電対策。 クリーンブース領域: ダスト・静電対策。 1.0t対応のクレーン(天井走行式) 1基。 床はエリアごとに仕様が異なる(要求水準書1-1)。 ドラフトチャンバーは、ヤマト科学CYV2-180V。 スクラバーは、ヤマト科学GRW3-19。 実験流し台はヤマト科学LSA-187。 遮光窓は、遮光カーテンB1であれば、可。 スクラバー、及びキャビネット以降の排気配管設備は学内基準準拠。 	
c	B2	16	分子流体力学分野実験室	クラスタ計算機などによるデータ処理を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 全体を、A・Bの2室に等分割する。以下、廊下側をA室、サービスヤード側をB室とする。 A室の天井はCH=3.0m、B室は直天井。 扉: 幅は(1,800)mm必要である。 書棚、物品棚、計算機棚には転倒防止措置を講じる。 情報コンセントはKUIINS-IIIのほか、別途10GBase-Tにて分子流体力学分野の他の室(c-2-9分子流体力学分野学生室、c-2-11分子流体力学分野教授室、c-2-12分子流体力学分野準教授室、c-2-13分子流体力学分野助教室)と直結する。そのための特殊配管を要する。 サービスヤード側搬入扉(H4,000mm×W3,000mm両開き小扉付き) 1箇所。 床: 耐薬品性ビニルシート等。 採光窓不要。 空調: A・B室で独立に制御可能とする。A室は計算機室レベルの空調(夏期20℃、冬期20℃)、B室は一般的な快適温度を目安とする(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃)。 実験用陶器製流し。 天井下にケーブルラックを設置。 	

エリア(室名)			用途	特殊条件	備考
c	B2	17	流体力学分野実験室 A室には、流体力学・構造材料強度に関連する数値シミュレーションを行うための、計算機を設置する。 計算機は、備考欄に記載するネットワークを用い、教員・学生居室から遠隔操作で運用を行う。通常は無人である。 B室には、使用頻度の低い研究資料や、計算機部品・実験装置部品等の保管を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 扉: H2,000mm×W1,800mm(両開き) 1.計算機が熱を出すため、A1、A2、A3室は冷却が必要である。計算機による発熱は50kWであるが、計算機の増設により、将来的に80kW程度が想定される。機器の故障率を下げるため、室温は低め(20°C±5°C)を保つ必要がある。 2.計算機がかなりの騒音を発するため、A室の壁面および天井に吸音材を用いる。 3.A1、A2、A3室の天井に、エアコン、若干の照明、電源コンセントおよび配線用のレール(あるいはラダー)を敷設する。省エネルギーのため、A1、A2、A3室のエアコンは独立して制御できるものとする。 4.計算機操作のため、関連分野教員・院生室とKUINS以外のネットワーク・ケーブルで直結する必要がある。ケーブルは、カテゴリ7を用い、各配線の延長は90m以内である必要がある。このケーブルは、将来の技術進歩に応じ、容易に交換できるように敷設する必要がある。 配線は以下の通り: 図 5.計算機操作のため、KUINS3の情報コンセントが2個必要である。流体力学分野はKUINS2も利用する。 6.電力供給は、全体で100V1000Aである。 ・サービスヤード側搬入扉(H4,000mm×W3,000mm両開き小扉付き)1箇所。B室をサービスヤード側に配置する。 ・床: 耐薬品性ビニルシート等。 ・直天、パーティションで一部分割(CH=3.0m)。 ・採光窓不要。 ・壁・天井に吸音対策(グラスウールマット等)。 ・特殊空調: 計算機が熱を出すため冷却が必要。現状50kwであるが、増設により将来的に80kw程度が想定される。(参考室-恒温室)温度20°C±5°C(湿度成り行き) ・実験用陶器製流し(作業後手洗いのため) ・空調機は単独制御出来ること。 ・計算機操作のため、関連分野教員、院生室とKUINS以外のネットワークを構築する。(CAT7) 	
c	B2	18	流体数理学分野実験室 流体(水)を用いた実験研究、計算機クラスタを用いた数値解析などを行なう。	<ul style="list-style-type: none"> 扉: H2,000mm、幅は(1,800(両開き))mm必要である。 ・計算機室: パネル壁面・天井(3m高)で囲む、OAフリーアクセス床とする。 ・サービスヤード側搬入扉(W1.8m×H2,100mm両開き扉)1箇所。 ・床: 耐薬品性ビニルシート等。床ドレン穴3箇所。 ・直天、パーティションで一部分割(CH=3.0m)。 ・空調設備: 夏期26°C、冬期22°C ・実験用ステンレス製流し(作業後の手洗い、装置・材料の洗浄)。 ・実験排水: 一般実験。 	
c	B2	19	制御工学分野実験室 システム制御工学に関連する実験を行う。当面は、脚ロボットを用いた歩行実験を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 扉: 両開きの幅は(2,000)mm必要である。 ・サービスヤード側搬入扉(H4,000mm×W3,000mm両開き小扉付き)1箇所。 ・床: 耐薬品性ビニルシート等。 ・直天井。 ・0.5t対応のクレーン(天井走行式)1基。 ・空調設備: 夏期26°C、冬期22°C ・実験用ステンレス製流し(作業後の手洗い、装置・材料の洗浄) ・実験排水: 一般実験(薬品系無し) ・クレーン: 100kg程度の装置運搬、取り扱い容易な0.5ton以下を希望。 	

エリア(室名)			用途	特殊条件	備考	
d	B2	1	共通実験室2	<p>実験装置の組立作業、混相流試験などの目的に用いる。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 特殊換気として 真空ポンプ排気接続用NW-40ステンレス配管継手を設けること。なお配管は壁面から50mm程度離すこと。 扉: 物理化学実験室3および共通実験室1への出入り扉は標準仕様W1,250mm(親子開き)各1箇所。 サービスヤード側搬入扉(H4,000mm×W3,000mm両開き小扉付)1箇所。 床: 耐薬品性ビニルシート等。 吊桟、排水ピット(実験排水の項も参照)。 各扉は壁面から概ね1m離して設置(ポンベ設置スペース確保)。 空調: 一般的な快適温度を目安とする。 特殊換気: 屋上ダクトファン設置 実験用陶器製流し 実験装置用給排水: 上水 25℃、30L/min+元圧5気圧、1箇所 実験排水: 30L/minの水を排水可能とする: 兼用グレーチング、15cmx15cm排水桟、100Aの排水管ピットへ接続 分電盤: 三相200V・100A、三相200V・50A、単相200V・50A、単相100V・30Aを各1箇所。 	
d	B2	2	共通実験室1	<p>実験装置の組立作業、性能試験などの目的に用いる。 スパッタ装置およびグローブボックスのための耐荷重補強が必要である。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ドラフトチャンバー: 幅1500 湿式スクラパー付 特殊換気として 真空ポンプ排気接続用NW-40ステンレス配管継手を設けること。なお配管は壁面から50mm程度離すこと。 スパッタ装置部グローブボックス部は耐荷重設計をすること。 扉: W900mm(片開き)×2箇所を、物理化学実験室2および共通実験室2に向けて設けること。 扉: W1200mm(親子開き)×1箇所を、物理化学実験室1に向けて設けること。 床: 耐薬品性ビニルシートF14。 サービスヤード側搬入扉(W1800mm×H2,100mm両開き扉、防犯ガラス窓付き)1箇所。 各扉は壁面から概ね1m離して設置(部屋の隅はポンベ設置スペース)。 空調: 一般的な快適温度を目安とする。 実験用陶器製流し800mm幅程度、蛇口3つ以上 実験装置用給排水: 上水 25℃、10L/min、1箇所。プラグ止め。 分電盤: 三相200V・30A x2、単相100V・40A x2 を1箇所。 	
d	B2	3	物理化学実験室3	<p>天井高は3.5m程度とすること。 表面にナノ・マイクロ多重多孔質層を施した板の伝熱促進性能の評価に関する実験を行う。 遮光カーテンを準備室側透明板部全体に設ける。 物理化学実験室2との間は通常の壁とする。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 隣接する部屋との間は、物理化学実験準備室との間を除き、通常の壁とする。 物理化学実験準備室との間の壁は、腰の高さ程度から下は通常壁、上を透明耐火ガラスとする。但し防火区画としての基準を満たす材質を用いること。 また、透明板部全面に遮光カーテンを設けること。 別表2に掲げた装置のうち、参考図に記載の無いものは、適宜実験台上で移動して用いる。参考図の配電盤まで電力を供給しておくこと。 扉: RD3仕様W1,250mm(親子開き)×2箇所 サービスヤード側搬入扉(W1,800mm×H2,100mm両開き扉程度)1箇所。 床: 耐薬品性ビニルシート等。 吊桟、排水ピット。実験排水: 30L/minの水を排水可能とする: 兼用グレーチング、15cmx15cm排水桟、100Aの排水管ピットへ接続 CH=3.5m。 各扉は壁面から概ね1m離して設置(ポンベ設置スペース確保)。 空調: 一般的な快適温度を目安とする。 実験用水及び機械洗浄のため。実験用ステンレス製流し 実験排水: 一般実験 排気: 局所排気が可能な一般排気口を設ける。 分電盤: 三相200V・100A、三相200V・50A、単相200V・50A、単相100V・30Aを各1箇所。 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
d	B2	4	物理化学実験室2	核材料物質の化学分析などを行なう。 物理化学実験準備室および共通実験室1への出入口を1箇所ずつ設けること。	<ul style="list-style-type: none"> ・ドラフトチャンバー:幅1200 湿式スクラーパー付。ドラフトチャンバーは部屋の角から1m以上離すこと(横で使用する機器を置くスペースの確保)。 ・特殊換気として 真空ポンプ排気接続用NW-40ステンレス配管継手を設けること。なお配管は壁面から50mm程度離すこと。 ・薬品室への貫通孔は、直径150mmφ程度で、床および天井からそれぞれ200mm程度離すこと。 ・隣接する部屋との間は、物理化学実験準備室との間を除き、通常の壁とする。 ・物理化学実験準備室との間の壁は、腰の高さ程度から下は通常壁、上を透明耐火ガラスとする。但し防火区画としての基準を満たす材質を用いること。 また、透明板部全面にブラインドを設けること。 ・分電盤:三相200V・80A、単相100V・40Ax2を1箇所。 ・扉:W900mm(片開き)×1箇所を、共通実験室1に向けて設けること。扉に窓を設けること。 ・扉:W1,250mm(親子開き)×1箇所を、物理化学実験準備室に向けて設けること。扉に窓を設けること。 ・床:耐薬品性ビニルシートF14。 ・CH=3m。 ・各扉は壁面から概ね1m離して設置(ポンベ設置スペース確保)。 ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・特殊換気設備:屋上ダクトファン設置 ・実験用ステンレス製流し800mm幅程度、蛇口3つ以上 ・実験排水:一般実験 ・特殊ガス配管:Ar配管を薬品室から、貫通孔を通して敷設。薬品室への直径150mmφ程度の貫通孔を2箇所設け、床および天井からそれぞれ200mm程度離れた高さとする。 ・実験装置用給排水:上水 25°C、10L/min、1箇所。プラグ止め。 	
d	B2	5-1	物理化学実験室1	各種物性測定、化学合成反応実験(酸・有機溶媒の使用)などを行なう。 物理化学実験準備室および共通実験室1への出入口を1箇所ずつ設けること。 薬品室との間の壁は通常の壁とし、パーティション仕様にしないこと。	<ul style="list-style-type: none"> ・ドラフトチャンバー:幅1500 湿式スクラーパー付。 ・クリーンベンチ使用:幅1300 ガスを用いる。 ・ドラフトチャンバーおよびクリーンベンチは隣接させること。また、部屋の角から1m以上離すこと(横で使用する機器を置くスペースの確保)。 ・特殊換気として 真空ポンプ排気接続用NW-40ステンレス配管継手を設けること。なお配管は壁面から50mm程度離すこと。 ・薬品室への貫通孔は、直径150mmφ程度で、床および天井からそれぞれ200mm程度離すこと。 ・隣接する部屋との間は、物理化学実験準備室との間を除き、通常の壁とする。 ・物理化学実験準備室との間の壁は、腰の高さ程度から下は通常壁、上を透明耐火ガラスとする。但し防火区画としての基準を満たす材質を用いること。 また、透明板部全面にブラインドを設けること。 ・分電盤:三相200V・80A、単相100V・40Ax2を1箇所。 ・扉:W1,200mm(親子開き)×1箇所を、共通実験室1に向けて設けること。扉に窓を設けること。 ・扉:W1,200mm(親子開き)×1箇所を、物理化学実験準備室に向けて設けること。扉に窓を設けること。 ・床:耐薬品性ビニルシートF14。 ・CH=3m。 ・各扉は壁面から概ね1m離して設置(ポンベ設置スペース確保)。 ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・特殊換気設備:屋上ダクトファン設置 ・実験用ステンレス製流し800mm幅程度、蛇口3つ以上 ・実験排水:一般実験 ・特殊ガス配管:Ar配管を薬品室から、貫通孔を通して敷設。薬品室への直径150mmφ程度の貫通孔を2箇所設け、床および天井からそれぞれ200mm程度離れた高さとする。 ・排気:局所排気が可能な一般排気口を設ける。 ・実験装置用給排水:上水 25°C、10L/min、1箇所。プラグ止め。 	

エリア(室名)			用途	特殊条件	備考	
d	B2	5-2	薬品室	<p>薬品管理、分析機器の真空および恒温装置の使用保管などを行なう。 薬品管理、分析機器、シリンダーキャビネットでのポンベ保管、真空および恒温装置の使用保管などを行なう。 物理化学実験準備室への出入口を設けること。 物理化学実験室1および2との間の壁は通常の壁とし、パーティション仕様にしなすこと。薬品室への直径150mm程度の真通孔を設け、床および天井からそれぞれ200mm程度離れた高さとする事。 局所排気が可能な強制排気口(NW-40ジョイント、OnOff制御付)を1箇所設ける。排気配管は壁面から100mm程度離すこと。 シリンダーキャビネット7㎡2本用を設置すること</p>	<ul style="list-style-type: none"> 物理化学実験室1および2への貫通孔は、直径150mmφ程度で、床および天井からそれぞれ200mm程度離すこと。 排気配管は壁面から50mm程度離すこと。 特殊換気として 真空ポンプ排気接続用NW-40ステンレス配管継手を設けること。なお配管は壁面から50mm程度離すこと。 扉: W850mm(片開き、窓を設けること) 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 実験装置用給排水: 上水 25°C、10L/min、1箇所。プラグ止め。 シリンダーキャビネット(物理化学実験室1ドラフトに接続口)7㎡2本用を設置すること 分電盤: 三相200V・30A、単相100V・30Ax2を1箇所。 防火区画としての基準を満たすこと。 	
d	B2	6	物理化学実験準備室	<p>各種実験のために用いる様々な試料(液体、固体(粉体)など)の化学前処理のため、濃酸および有機溶媒の使用し、また加熱などの操作を行う。 また卓上の装置を用いた各種分析も行う。 建物外部への西側出入口(片開き850mm)を1箇所設ける。</p>	<ul style="list-style-type: none"> シリンダーキャビネット(ドラフトに接続口)7㎡2本用を設置すること。 分電盤: 三相200V・40A、単相100V・30Ax2を2箇所。 物理化学実験室1～3との間の壁は、腰の高さ程度から下は通常壁、上を透明耐火ガラスとする。但し防火区画としての基準を満たす材質を用いること。また、透明板部全面にブラインドを設けること。 扉: 廊下出入口(両開き1800mm2箇所、カード電気錠を設けること。窓を設けること)。 扉: 物理化学実験室1～3へ(親子開き1250mm)、薬品室へ(片開き850mm)。 建物外部への西側出入口(片開き850mm)を1箇所設ける。 床: 耐薬品性ビニルシートF14。 CH=3.0m。 各扉は壁面から概ね1m離して設置(ポンベ設置スペース確保)。 空調: エアコン2台、2箇所の出入り口で独立の操作盤(別系統)とする。廊下側出入り口2箇所に照明およびエアコンスイッチを設けること。 特殊換気: 屋上ダクトファン設置、スクラパー(排ガス洗浄装置)。局所排気用SWを設ける。 実験用ステンレス製流し×2基、1200mm幅程度、蛇口3つ以上 給湯: 家庭用湯沸器程度の電気温水器2箇所を実験流しに置くこと。 実験排水: 一般実験用 スクラバ付ドラフトチャンバー2基: 1800mm。部屋の両端に1箇所ずつ設けること。これらに給湯装置付実験流しを併設。 ドラフトチャンバーおよび流しは部屋の角から1m以上離すこと(ドラフト横で使用する機器を置くスペースの確保)。 環境試料粉碎による埃を回収するための局所換気扇(レンジフード状1m角程度、床上2m、フィルター等無し、OnOffスイッチ付)を1箇所設ける。排気口下の床面には配管などの突起物が無いこと。 実験装置用給排水: 上水 25°C、10L/min、1箇所。プラグ止め。場所は参考図参照。 天井面の配線ダクト(1φ100V20A 2回路、1φ200V30A 2回路)を設置 	
d	B2	7	クリーンルーム前室	<p>中性子実験参考文献の保管、実験用試料の作成、制御ソフトの開発、半導体の育成、加工、電気特性測定などを行う。 またクリーンルーム前室の役割として、更衣室、エアシャワー室を設置する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 実験室兼、クリーンルームへ入室するための部屋。 扉: W1,250mm(親子開き) 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 実験用ステンレス製流し 実験排水: 一般実験 特殊ガス: He回収 廊下から入室する。片開きの扉をもうける。 物品搬入のため、廊下へ通じる両開き扉をもうける。 クリーンルームへは、更衣室、エアシャワー室を通過して、入室する。クリーンルームへ物品を搬入するため、両開き扉を廊下側、クリーンルーム側の両側にもうける。 	

エリア(室名)			用途	特殊条件	備考	
d	B2	8	クリーンルーム機械室	<p>クラス1000のクリーンルームを維持するため、エアフィルタで空気を清浄にし、クリーンルームへ送風する。</p> <p>また、クリーンルーム内で動作するロータリーポンプの排気をクリーンルーム機械室へ導き、ここで排気する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・クリーンルームをクラス1000の清浄度とするため、空気フィルタ装置を設置し、空気を清浄化したのち、クリーンルームへ送風する。 ・クリーンルーム内で動作するロータリーポンプなどの排気をクリーンルーム機械室へ導き、ここで排気する。 ・クリーンルーム内で使用する高圧ガス用のガスポンペをクリーンルーム機械室に配置する。 ・クリーンルームとの壁に高圧ガス用の配管を1/4インチ管で4系統もうけ、高圧ガスをクリーンルームへ供給する。 	
d	B2	9	クリーンルーム	<p>クラス1000の清浄環境において、放射線検出器母材の加工、測定を行う。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・クラス1000のクリーン度。 ・ドラフトに吸引する空気は、クリーンルームの空気とする。 ・ほこりを含む外気を吸引しないこと。 ・酸用ドラフトと有機用ドラフトを個別に運転できるようにする。 ・ロータリーポンプ(真空ポンプ)の排気をクリーンルームの外へ導くダクトを設ける。 ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・特殊空調設備:クリーンルーム クラス1000 ・特殊換気:酸用、有機用常時排気 ・ドラフトチャンバー:幅1500 スクラバー(排ガス洗浄装置) ・実験用ステンレス製流し ・実験排水:一般実験 ・特殊ガス:He回収 ・クリーンルーム前室からは、更衣室、エアシャワー室を通過し、入室する。物品搬入のため、クリーンルーム前室からクリーンルームへ通じる両開き扉をもうける。 	

エリア(室名)			用途	特殊条件	備考
d	B2	10-1	機械工作室	<p>機械系研究室の研究支援にかかわる装置の設計、製作を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> 加工物によっては、油煙が発生するため、回転数可変の換気扇を設ける。(インバータ)平面研削盤設置部分は、別部屋または間仕切り、局所排気装置を付ける。 溶接場を別部屋または間仕切り別途換気扇をつける。 床は、耐油性で滑りにくいもの。 床面に機器への配線ビッド(溝)を設ける。 照明は、水銀灯をメインとし、壁面に補助蛍光灯を設置。水銀灯は交換を考慮し、昇降式とする。 空調は標準的なもので良いが、夏季に機器が同時稼働した際、26℃以上にならないように考慮する。 壁は、防音対策を施す。(外に騒音ができるだけ漏れない) シャワーリング設置のために、コンクリート土台およびアンカー工事必要。 直立ボール盤設置のために、アンカー工事必要。 ワイヤー放電およびマニングセンターはノイズ対策のため、アースは独立とする。 情報コンセント設置。 扉：・W1,250mm(親子開き) 廊下との出入り口と10-2機械工作室控室との出入り口を設ける 床：耐薬品性ビニルシート等。 サービスヤード側搬入扉(W3,000mm×H4,000mm両開き小扉付き)1箇所。 防音仕様。壁・天井に吸音対策(グラスウールマット等)。 実験用陶器製流し(油汚れが多いため、各流しには温水が必要。) 都市ガス設備：要 給湯設備：ガス給湯器(10-2機械工作室控室とどちらかに1台設置) 実験排水：RI 特殊ガス配管：溶接用配管設備(アルゴン、酸素、アセチレン) ボンベ室を設け、溶接場へ3系統のガス配管を設ける。 10-2機械工作室控室との間にドア、窓を設ける。 10-2機械工作室控室との間に電源ケーブル等が通せる配管を設置する。 <p>(2階ロフト設置した場合)</p> <ul style="list-style-type: none"> ホイスト取り付け土台必要。 材料や自動車エンジン等の保管に耐えうる床が必要。 ホイスト設置のため天井高3m必要。 ホイスト設置位置より半径2.5mは天井付近でアームが回転するため、水銀灯との干渉に注意が必要。 高さ1,100mmの柵を設け、開閉式にする。 材料や実習用自動車エンジンなどを保管できる程度の床耐荷重が必要。 クレーン：トン数 0.2 t 形式 既存設備の移設 0.2t対応のクレーン(天井走行式)1基。 	
d	B2	10-2	機械工作室控室	<ul style="list-style-type: none"> 空調：一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 洗面台、ミニキッチン、ユニットバス、洗濯機パン設置 洗濯機用給水は、お湯が使えること。 機械工作室内が見えるように、透明ガラス窓を設置し、ロールスクリーンをつける。 壁掛けテレビ用金具が取り付けられる強度が必要 床はOAフロアとし、高さは10cm程度(入口ドア付近で段差を付ける) OAフロア下に4か所100Vコンセントを設置 給湯設備：ガス給湯器(10-2機械工作室控室とどちらかに1台設置) 10-1機械工作室との間にドア、窓を設ける。 10-1機械工作室との間に電源ケーブル等が通せる配管を設置する。 	

エリア(室名)			用途	特殊条件	備考	
d	B2	11	機械系共通計算機室	<p>機械システムに関するシミュレーション研究を行うための並列計算機・ワークステーション・パソコンを配置する。</p> <p>複数の研究室・教員室あるいは学外からネットワークを介して操作できる必要があり、KUIINS2およびKUIINS3への接続が可能とする。</p> <p>また、大規模シミュレーションによる解析データ量は、数十ギガバイトを超えるため、計算機室内の計算機と各居室とが、KUIINSに加えて、ギガビット以上の高速回線で接続可能な仕様を必要とする。</p> <p>障害が生じた際には、計算機室で作業を行う必要があるため、簡単な作業スペースが必要である。</p> <p>消費電力と廃熱が膨大であるため大きな電源容量と強力な空調設備が不可欠である。</p> <p>また、数ヶ月に及ぶ長時間計算が停電や電源電圧ノイズによって途切れないように、電源電圧の安定化を必要とする。</p> <p>さらに、計算機のファンによって大きな騒音が出るため、壁と出入り口には遮音対策が施されている必要がある。</p> <p>空調機の障害時に部屋の温度が急激にあがらないように、空調機は2系統以上配置する。</p>	<p>・参考図の電源コンセント以外に、以下の要領のコンセントを床下にはわせる。</p> <p>・特殊電源</p> <ul style="list-style-type: none"> ・100V20A-E付 x 100 ・200V20A-E付 x 10 ・200V30A-E付 x 10 ・三相200V電源60A x 6(予備) ・通常電源100Vx100 <p>・情報コンセントは電話付近のもののみAタイプ</p> <p>・その他はBタイプ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各研究室、学外からのアクセスに対応すること。 ・セキュリティレベルは各研究室個別に設定が可能とすること ・効果的に空調を行うために、ラックマウントサーバと空調機の位置関係に注意のこと。 ・ラックマウントサーバが前面から、空調機からの冷風を取り入れることができるように配慮すること。 ・扉:W1,250mm(親子開き) ・配線ビット。 ・防音仕様。 ・壁・天井に吸音対策(グラスウールマット等)。 ・電気錠。 ・窓不要。 ・特殊空調設備:恒温恒湿 18℃±2℃ ・洗面化粧台 ・ギガビット以上の高速ネットワーク回線が必要 ・電子錠 	
d	B2	12	欠番			
d	B2	13	メカトロニクス分野実験室	<p>ロボットのハードウェアとソフトウェアの開発と実験に使用。</p> <p>サービスヤード側の搬入出口の大きさは幅3m、高さ4m程度とする。</p> <p>重量物の搬入出のためサービスヤードと実験室に段差のないようにする。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・扉:H2,000mm・W1,250mm(親子開き) ・床:防塵塗床あるいは耐薬品性ビニルシート等。 ・サービスヤード側搬入扉(W3,000mm×H4,000mm両開き小扉付き)1箇所。 ・防音仕様。 ・壁・天井に吸音対策(グラスウールマット等)。 ・採光窓要。可能であればハイライトに加えて腰窓も希望。 ・0.5t対応のクレーン(ポスト型ジブクレーン)1基。 ・床配線ビット(室周囲と中央十字に配置W100×H50程度)。 ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。夏期26℃、冬期22℃ ・実験用陶器製流し、実験用ステンレス製流し(実験器具洗浄、手洗い) ・給湯設備:家庭用湯沸器程度 電気温水器(ステンレス流しの各所) ・特殊ガス設備:圧縮空気(コンプレッサによる圧縮空気を使用するロボットがある為) ・コンプレッサ用に防音室の設置を希望。ただし圧縮空気が共同配給となれば防音室は必要ない。 ・200V(3相、単相)40Aの分電盤が4つ必要。 ・100Vについては今後の装置の拡張を考慮して現状の3倍程度(単1500、三500)の電流容量を希望する。 ・ホイストクレーンと干渉しない天井部には格子状にリーラコンセントを配置。 ・廊下に展示パネル用レールを設置(4m)。 	

エリア(室名)			用途	特殊条件	備考	
d	B2	14	材料実験室3	材料表面の蒸着等試料調整、表面分析	<ul style="list-style-type: none"> 扉: W1,250mm(親子開き) 一カ所 ・サービスヤード側搬入扉(W2,000mm×H2,500mm両開き扉)1箇所。 ・床: 耐薬品性ビニルシート等。 ・床: 一部補強要(1.5t対応)。 ・壁コンセントは全て高さ900mm ・採光窓要。 ・空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。夏期26℃、冬期22℃ ・実験用ステンレス製流し1台 ・実験装置用給排水: 実験機器冷却のため必要。上水でバルブ止め。 ・実験排水: 一般実験 ・天井リレーコンセントを設置。 ・天井リレーコンセントを設置。 ・分電盤: φ1-100 20A×6, φ1-200 50A + 20A, φ3-200 20A + 40A を一カ所に設置。 ・別表2に掲げた装置のうち、参考図に記載の無いものは、適宜実験台上で移動して用いる。参考図の配電盤まで電力を供給しておくこと。 	
d	B2	15	材料実験室2	固体材料の切断、研磨、打抜き、薄片化などの試料調整作業を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 扉: W1,250mm(親子開き) 一カ所 ・防火区画としての基準を満たすこと。(防火戸、ダクトへのダンパー設置など) ・壁コンセントは全て高さ900mm ・床: 耐薬品性ビニルシート等。 ・採光窓可。 ・空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。夏期26℃、冬期22℃ ・実験用ステンレス製流し2台 ・実験装置用給排水: 実験機器冷却のため必要。上水でバルブ止め。 ・実験排水: 一般実験 ・給湯設備: 家庭用湯沸器・電気温水器) 一台 ・天井リレーコンセントを設置。 ・分電盤: φ1-100 15A + 20A + 30A を一カ所に、φ1-100 15A をもう一カ所に設置。 ・別表2に掲げた装置のうち、参考図に記載の無いものは、適宜実験台上で移動して用いる。参考図の配電盤まで電力を供給しておくこと。 	
d	B2	16	材料実験室1	核融合炉材料とプラズマとの相互作用、原子炉材料の安全性評価などに関する実験を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 扉: W1,250mm(親子開き) ・防火区画としての基準を満たすこと。(防火戸、ダクトへのダンパー設置など) ・エアコンは2機以上で、独立にON-OFFできること。 ・照明スイッチは扉付近に2カ所配置し、それぞれ図面の左側、右側に対応していること。 ・壁コンセントは全て高さ900mm ・床: 耐薬品性ビニルシート等。採光窓可。 ・空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。夏期26℃、冬期22℃ ・ドラフトチャンバー: 幅1200 スクラバー(排ガス洗浄装置) ・実験用ステンレス製流し2台 ・実験装置用給排水: 実験機器冷却のため必要。上水でバルブ止め。 ・実験排水: 一般実験 ・天井リレーコンセントを設置。 ・天井リレーコンセントを設置。 ・分電盤: φ1-100 20A×2, φ1-200 10A を一カ所に、φ1-100 20A×2 をもう一カ所に、φ1-100 20A×3 をもう一カ所に設置。 ・別表2に掲げた装置のうち、参考図に記載の無いものは、適宜実験台上で移動して用いる。参考図の配電盤まで電力を供給しておくこと。 	

エリア(室名)			用途	特殊条件	備考	
d	B2	17	機器保管室	試験装置・大型資材の保管・整備などを行う。	<ul style="list-style-type: none"> 扉: W1,800mm(両開き) 床: 耐薬品性ビニルシートF14。 採光窓可。 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。夏期26℃、冬期22℃ 実験用ステンレス製流し 実験排水: 一般実験 分電盤: 三相200V・50A、単相100V・30Ax2 を1箇所。 	
d	B2	18	試料調整室	教育研究用の装置や試料の作成また装置の組み立て調整等を行う。 また、実験装置や加工機等の保管もするため、重量物を設置するため、一部耐荷重の強化を必要とする。	<ul style="list-style-type: none"> 中央部作業台は天井吊り下げ型コンセントとする。また、三相200V30Aも、中央部でも使用する。 実験分電盤(添付参考図面を参照のこと)は壁に取り付け、そこから配線して装置の近くにブレーカーを設置のこと。 ただし、この場合は分電盤を左右壁もしくは入り口側などに2か所以上で分散設置のこと。 床は水や油汚れが拭き取りやすい素材とする。 棚は重量棚等とし工作機械部品(ジグ等)や工具、ほかには材料を置く棚とするため、壁や天井などと強固に固定する事。 複数の工作機械や装置を同時に使う(設置する)ので、コンセントは各装置近くに不足の無いように通常の実験室より多めに設置。 扉: H2,000mm、W1,800mmの入り口が2か所は必要である(親子開き) 床: 耐薬品性ビニルシート等。 採光窓可。 防音仕様。 壁・天井に吸音対策(グラスウールマット等)。 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。夏期26℃、冬期22℃。 換気: 集塵機5回/h 実験用陶器流し。サイズは800×500×深さ150程度を目途に設置する。給湯器を設置する。 実験装置用給排水: 実験機器冷却のため必要。 実験排水: 一般実験 水道と排水栓: 白衣、作業着、タオルその他の洗濯を行う為、洗濯機を設置するため、蛇口と床上排水栓を設置する。 	
d	B2	19	原子核工学計算機室	通信用サーバ、研究用計算機、冷却装置などを設置する。相当数のPC、電気機器が配置され、同時使用される。	<ul style="list-style-type: none"> 別表2に掲げた装置のうち、参考図に記載の無いものは、適宜作業台上で移動して用いる。 扉: W1,800mm(両開き)×廊下へ2箇所 メインサーバ用エリアは施錠可能なパーティションにて区画(3.0m×4.0m程度)。 電源拡張対策: 部屋南側(廊下と反対側)に、壁コンセント容量とは別に、100V20Ax5 200V30Ax1の分電盤を4箇所、等間隔(参考図参照)に設置し、追加供給しておくこと。 ダクトスペースにより、地上1階および2階の各分野教員室(計6箇所)まで専用配管を敷設すること。LANケーブル等を敷設する予定。 当該区画は特殊空調設備を敷設すること。多くの大型計算機の安定な同時稼働に対応した、複数系統の空調(複数台のエアコンとし、停電後の自動復帰を行うものとする)を附帯設備とすること。 床: 耐薬品性ビニルシートF14。採光窓可。ブラインドを設けること。 実験装置用給排水: 上水 25℃、10L/min、1箇所。プラグ止め。 配線ビッド: 床に情報コンセントおよび分電盤を起点に格子状に配置すること。 	
d	B2	20	文書保存室	文書の複写およびそれらの一時保管などを行う。	<ul style="list-style-type: none"> 書架部分には耐荷重の強化1000kgが必要である。 扉: W1,800mm(両開き) 床: 耐薬品性ビニルシートF14。採光窓可。ブラインドを設けること。 照度は500ルクス以上とする。照明器具は均等・等間隔に配置し、机や書架の配置を自由に変えられるようにする。 書架レイアウトにあった照明配置。参考図を参照。 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。夏期26℃、冬期22℃ 洗面化粧台 実験装置用給排水: 上水 25℃、10L/min、1箇所。プラグ止め。 	

エリア(室名)			用途	特殊条件	備考	
d	B2	21	客員実験室1	客員教員・研究者用実験室として使用する。	<ul style="list-style-type: none"> ・扉:幅は(2,000)mm必要である ・分電盤2面。 ・単相200Vファクトライン用 30A (6kW) 2回路。 ・単相100Vファクトライン用 20A (2kW) 2回路。 ・単相200V実験用 50A (10kW) 1回路。 ・単相200V実験用 30A (6kW) 3回路。 ・単相100V実験用 50A (5kW) 1回路。 ・単相100V実験用 30A (3kW) 3回路。 ・単相100Vコンセント 20A (2kW) 4回路。 ・単相100V予備 20A (2kW) 2回路。 ・三相200V実験用 50A (17kW) 2回路 ・三相200V実験用 30A (10kW) 1回路。 ・床:耐薬品性ビニルシート等。 ・床排水側溝。 ・パーティションにて分割。 ・高度空調 ・ドラフトチャンバー:幅1800×3台 スクラバー(排ガス洗浄装置) ・実験用陶器製流し、実験用ステンレス製流し(実験器具洗浄、手洗い) ・実験装置用給排水:実験機器冷却のため必要。 ・都市ガス設備:実験機器の加熱のため必要。 ・給湯設備:家庭用湯沸器程度 電気温水器 ・実験排水:一般実験 ・特殊ガス配管:He回収(Heクライオスタット使用時のHeガス回収のため) ・液体窒素利用。 ・部屋の吸気口にはクラス100000のフィルターを設置 ・天井面の配線ダクト(1φ100V20A 2回路、1φ200V30A 2回路)を設置 	
d	B2	22	廃棄物品置場	機械系4専攻が使用する廃棄物品保管庫	<ul style="list-style-type: none"> ・大型廃棄物・一般廃棄物・紙・資源廃棄物の4つに区切り、それぞれ屋外に面して扉を設置する。 ・一般廃棄物は空調(一般的な快適温度を目安とする。)及び換気設備を備える。 ・空調・換気は独立とすること。 ・紙類・資源廃棄物はそれぞれ内部を4つ～8つに区切る。 ・資源廃棄物、一般廃棄物の床は洗浄できるように、それぞれ給排水設備を備えること。 	
a	B1	1	ゼミ室	大学院のセミナー、研究会を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・スクリーンに対して前後方向に分割して天井灯を制御可能 ・扉:H2,000mm×W850mm(片開き) ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 ・プロジェクタとPCを接続するための信号線を配線し、そのコネクタ部を電動スクリーン近くの壁面に設ける。 ・パイプスペースや柱などにより白板、スクリーンに隠れが発生しないこと。 	
a	B1	2	ゼミ室	大学院のセミナー、研究会を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・スクリーンに対して前後方向に分割して天井灯を制御可能 ・扉:H2,000mm×W850mm(片開き) ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 ・プロジェクタとPCを接続するための信号線を配線し、そのコネクタ部を電動スクリーン近くの壁面に設ける。 ・パイプスペースや柱などにより白板、スクリーンに隠れが発生しないこと。 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
a	B1	3	ゼミ室	大学院のセミナー、研究会を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・スクリーンに対して前後方向に分割して天井灯を制御可能 ・扉: H2,000mm × W850mm(片開き) ・空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 ・プロジェクタとPCを接続するための信号線を配線し、そのコネクタ部を電動スクリーン近くの壁面に設ける。 ・パイプスペースや柱などにより白板、スクリーンに隠れが発生しないこと。 	
a	B1	4	ゼミ室	大学院のセミナー、研究会を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・スクリーンに対して前後方向に分割して天井灯を制御可能 ・扉: H2,000mm × W850mm(片開き) ・空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 ・プロジェクタとPCを接続するための信号線を配線し、そのコネクタ部を電動スクリーン近くの壁面に設ける。 ・パイプスペースや柱などにより白板、スクリーンに隠れが発生しないこと。 	
a	B1	5	ゼミ室	大学院のセミナー、研究会を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・スクリーンに対して前後方向に分割して天井灯を制御可能 ・扉: H2,000mm × W850mm(片開き) ・空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 ・プロジェクタとPCを接続するための信号線を配線し、そのコネクタ部を電動スクリーン近くの壁面に設ける。 ・パイプスペースや柱などにより白板、スクリーンに隠れが発生しないこと。 	
a	B1	6-1	物理系暫定図書室	<p>図書室として用いる。 書架、事務スペース、資料閲覧・情報検索スペース等を置く。 書架スペースの耐荷重は1200kg/m²とすること。 できるだけ正方形に近い形状であることが望ましい。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・扉: H2,000mm・W1,250mm(出入口、親子開き)・W850mm(非常口、片開き)、W1250mm(図書職員作業室へ、親子開き)の3箇所。 ・床: タイルカーペット。 ・電気錠。 ・天井・壁に吸音対策(化粧有孔板グラスウール充填等、岩吸板等)。 ・空調設備: 一般的に快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台(出入口横)およびステンレス流し台(パーティション内)を1ヶずつ設置すること。配置は参考図面を参照のこと。 ・給湯設備: 電気温水器(家庭用程度) ・パイプスペースのための出っ張りや柱は出来るだけ少なくすること。 ・出入口以外に非常口を1箇所以上設けること。 ・壁はクロス張りとし、外部の音が高度に遮断された空間、配置とすること。 ・書架の高さが高いため、天井照明器具の配置は書架の向きと垂直な方向とすること。参考図参照のこと。 ・なお、これに従えば、東西方向に照明を配置することになる。これは書架直上に平行に位置すると、通路・陳列書籍を十分な明るさで照らすことができないためである。 ・通路照度は500ルクス以上とする。照明器具は均等・等間隔に配置し、机や書架の配置を自由に換えられるようにする。 ・窓面による自然採光の活用、局所的な補助採光等を十分考慮する。ブラインドを設置すること。 ・出入口に入退室管理システムを設置すること。 ・閲覧カウンター奥に、3x3m程度のパーティションで区画された部屋を設け、施錠できるようにすること。但し、上部500mm程度は開放すること。またその中にミニキッチン、温水器を設置すること。 ・窓ガラスは透明とする。 ・閲覧机および事務机付近に床コンセント(単100V/20A)を設置すること。 	
a	B1	6-2	図書職員作業室	図書掛の作業スペース、物品および書籍の一時保管場所として用いる。	<ul style="list-style-type: none"> ・空調: 一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) ・洗面台 ・廊下への出入口は無いが、物理系暫定図書室への出入口を設ける。窓ガラスは透明とする。ブラインドを設ける。 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
a	B1	7	シャワー室	物理系4専攻の教職員が利用するシャワー室	<ul style="list-style-type: none"> 床: 防水、防かび 壁: 防水、防かび 天井: 防水、防かび シャワーユニット最低2ヶ所 それぞれのユニットに脱衣場、緊急時に防災センター、事務室につながる警報 給湯設備: シャワー用給水 	
a	B1	8	ゼミ室		<ul style="list-style-type: none"> スクリーンに対して前後方向に分割して天井灯を制御可能 扉: H2,000mm × W850mm(片開き) 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 プロジェクタとPCを接続するための信号線を配線し、そのコネクタ部を電動スクリーン近くの壁面に設ける。 パイプスペースや柱などにより白板、スクリーンに隠れが発生しないこと。 	
a	B1	9	ゼミ室	大学院のセミナー、研究会を行う。	<ul style="list-style-type: none"> スクリーンに対して前後方向に分割して天井灯を制御可能 扉: H2,000mm × W850mm(片開き) 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 プロジェクタとPCを接続するための信号線を配線し、そのコネクタ部を電動スクリーン近くの壁面に設ける。 パイプスペースや柱などにより白板、スクリーンに隠れが発生しないこと。 	
a	B1	10	用務員控室	建物の用務員の控え室	<ul style="list-style-type: none"> 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 家庭用ステンレス製流し台 給湯設備: 電気給湯器(家庭用程度) ブラインドを設置すること 	
b	B1	1	講義室2	大学院の講義を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 黒板は左右2面、それぞれ2枚の上下可動式。 照明は黒板灯と前後独立に制御可能な天井灯で、天井灯は照度が可変。 窓の暗幕は前後独立に電動開閉可能。 ワイヤレスマイクを3チャンネル以上使用可能。 教卓とパソコン等を設置するための準備卓を備える。 準備卓は電源、プロジェクターケーブル端子、スピーカー入力端子を備える。 照明制御、暗幕制御、スクリーン制御は、準備卓近くで可能。 扉: H2,000mm × W850mm(片開き) 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 映像音声収納ラックに次の外部配線必要。 <ul style="list-style-type: none"> 1) 非常カット信号(防災アンプより) 2) 校内LAN(2系統)、そのうち一つは遠隔講義専用光ファイバ回線 3) 共聴ライン 映像音声機器収納ラックに電源としてAC100V20A × 4回路必要 プロジェクタとPCを接続するための信号線を配線し、そのコネクタ部を電動スクリーン近くの壁面に設ける。 パイプスペースや柱などにより黒板(白板)、スクリーンに隠れが発生しないこと。 空調・換気音は最低限に抑えること。 机には人数分の電源コンセント、ネットワークコンセントを備える。このために必要な配線を床に施す。 ロビー側壁面(扉部分を除く全面)に掲示板及び専用照明を設置する。また講義室2と講義室3の掲示板の半数は前面がガラス張りで鍵により施錠できること。 	

エリア(室名)			用途	特殊条件	備考
b	B1	2 講義室3	大学院の講義を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 黒板は左右2面、それぞれ2枚の上下可動式。 照明は黒板灯と前後独立に制御可能な天井灯で、天井灯は照度が可変。 窓の暗幕は前後独立に電動開閉可能。 ワイヤレスマイクを3チャンネル以上使用可能。 教卓とパソコン等を設置するための準備卓を備える。 準備卓は電源、プロジェクターケーブル端子、スピーカー入力端子を備える。 照明制御、暗幕制御、スクリーン制御は、準備卓近くで可能。 扉: H2,000mm × W850mm(片開き) 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 映像音声収納ラックに次の外部配線必要。 <ol style="list-style-type: none"> 1) 非常カット信号(防災アンプより) 2) 校内LAN(2系統) 3) 共聴ライン 映像音声機器収納ラックに電源としてAC100V20A × 4回路必要。 プロジェクタとPCを接続するための信号線を配線し、そのコネクタ部を電動スクリーン近くの壁面に設ける。 パイプスペースや柱などにより黒板(白板)、スクリーンに隠れが発生しないこと。 空調・換気音は最低限に抑えること。 机には人数分の電源コンセント、ネットワークコンセントを備える。このために必要な配線を床に施す。 ロビー側壁面(扉部分を除く全面)に掲示板及び専用照明を設置する。また講義室2と講義室3の掲示板の半数は前面がガラス張りです。鍵により施錠できること。 	
b	B1	3 量子物性学分野院生室		<ul style="list-style-type: none"> 扉: W1,250mm(親子開き) 床: OAフロアH100 システムキッチン(W1500程度) パーティションにて区画(※) 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 	
b	B1	4 量子物性学分野実験室	量子物性、量子化学シミュレーション 数値計算に必要なワークステーションを設置するとともに、端末を置いて主に学生がプログラム開発を行い、計算を実行する部屋である。 シミュレーションに関する議論が十分に行えるようにホワイトボード・大型テレビを壁に設置し、書架を設置して多くの専門書や専門雑誌を置くようにする。	<ul style="list-style-type: none"> 扉: W1,250mm(親子開き) OAフロアは希望しません。 床: タイルカーペット。 ガラスパーティションにより分割(腰部は壁)。 特殊空調: 通年18°C程度。ワークステーションの冷却。計算機室と同レベル(50+50+50)予備機有り。 バックアップ電源が必要。 液晶テレビ等でパソコン端末が映し出されるネットワークの構築。 	
b	B1	5 ゼミ室	大学院のセミナー、研究会を行う。	<ul style="list-style-type: none"> スクリーンに対して前後方向に分割して天井灯を制御可能。 扉: H2,000mm × W850mm(片開き) 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台。 プロジェクタとPCを接続するための信号線を配線し、そのコネクタ部を電動スクリーン近くの壁面に設ける。 パイプスペースや柱などにより白板、スクリーンに隠れが発生しないこと。 	
b	B1	6 機械システム創成学講座院生室	文献・調査資料を用いた研究、パソコンによるデータ処理、設計等を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 扉: W1,250mm(親子開き) 床: OAフロアH100 空調設備: 一般的に快適温度を目安とする。 家庭用ステンレス流し 給湯設備: 家庭用湯沸器程度 電気温水器 	

エリア(室名)			用途	特殊条件	備考	
b	B1	7	機械システム創成学 講座実験室	ロボット(産業用ロボット、無人ヘリコプタ)の制御、遠隔操作に関する実験、実験装置の試作を行う。 ロボット(産業用ロボット、無人ヘリコプタ)の制御に関するコンピュータシミュレーション、機械製品のユーザビリティ評価のためのデータ収集実験ならびに解析評価シミュレーションを行う。	扉: W1,800mm(両開き) ・空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 ・実験排水: 一般実験	
b	B1	8	カフェテリア	Cクラスター全員の利用のためのカフェテリア。簡単な飲食物を提供する。	・開放的であること。ただし、ロビーとの境界は明示すること。	
b	B1	9	購買	Cクラスター全員の利用のための購買部。		
b	B1	10	喫煙スペース	建物を利用する人の喫煙場所	・床: ヤニ等の汚れ除去が容易であること。 ・壁: ヤニ等の汚れ除去が容易であること。 ・天井: ヤニ等の汚れ除去が容易であること。 ・独立換気、喫煙スペース内は負圧とし、廊下側に空気がもれないこと。 ・ガラス壁	
b	B1	11	ゼミ室	大学院のセミナー、研究会を行う。	・スクリーンに対して前後方向に分割して天井灯を制御可能 ・扉: H2,000mm×W850mm(片開き) ・空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 ・プロジェクタとPCを接続するための信号線を配線し、そのコネクタ部を電動スクリーン近くの壁面に設ける。 ・パイプスペースや柱などにより白板、スクリーンに隠れが発生しないこと。	
b	B1	12	ゼミ室	大学院のセミナー、研究会を行う。	・スクリーンに対して前後方向に分割して天井灯を制御可能 ・扉: H2,000mm×W850mm(片開き) ・空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 ・プロジェクタとPCを接続するための信号線を配線し、そのコネクタ部を電動スクリーン近くの壁面に設ける。 ・パイプスペースや柱などにより白板、スクリーンに隠れが発生しないこと。	
b	B1	13	ゼミ室	大学院のセミナー、研究会を行う。	・スクリーンに対して前後方向に分割して天井灯を制御可能 ・扉: H2,000mm×W850mm(片開き) ・空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 ・プロジェクタとPCを接続するための信号線を配線し、そのコネクタ部を電動スクリーン近くの壁面に設ける。 ・パイプスペースや柱などにより白板、スクリーンに隠れが発生しないこと。	
b	B1	14	量子物性学分野教授室		・床: タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
b	B1	15	量子物性学分野准教授室		<ul style="list-style-type: none"> 床:タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 	
b	B1	16	量子物性学分野助教室		<ul style="list-style-type: none"> 床:タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 	
b	B1	17	ゼミ室	大学院のセミナー、研究会を行う。	<ul style="list-style-type: none"> スクリーンに対して前後方向に分割して天井灯を制御可能。 扉:H2,000mm×W850mm(片開き) 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 プロジェクタとPCを接続するための信号線を配線し、そのコネクタ部を電動スクリーン近くの壁面に設ける。 パイプスペースや柱などにより白板、スクリーンに隠れが発生しないこと。 	
b	B1	18	ゼミ室	大学院のセミナー、研究会を行う。	<ul style="list-style-type: none"> スクリーンに対して前後方向に分割して天井灯を制御可能。 扉:H2,000mm×W850mm(片開き) 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 プロジェクタとPCを接続するための信号線を配線し、そのコネクタ部を電動スクリーン近くの壁面に設ける。 パイプスペースや柱などにより白板、スクリーンに隠れが発生しないこと。 	
b	B1	19	ゼミ室	大学院のセミナー、研究会を行う。	<ul style="list-style-type: none"> スクリーンに対して前後方向に分割して天井灯を制御可能。 扉:H2,000mm×W850mm(片開き) 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 プロジェクタとPCを接続するための信号線を配線し、そのコネクタ部を電動スクリーン近くの壁面に設ける。 パイプスペースや柱などにより白板、スクリーンに隠れが発生しないこと。 	
b	B1	20	機械システム創成学講座教授室		<ul style="list-style-type: none"> 床:タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 	
b	B1	21	機械システム創成学講座准教授室		<ul style="list-style-type: none"> 床:タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 	
b	B1	22	機械システム創成学講座助教室		<ul style="list-style-type: none"> 床:タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
c	B1	1	事務室	物理系4専攻全分野が共通に利用する事務室	<ul style="list-style-type: none"> 扉: H2,000mm×W1,250mm(親子開き) 床: OAフロアH100、タイルカーペット。 ミーティングルームとの壁は全面ガラス(型硝子あるいは半透明フィルム貼り)。 廊下側の扉は両引きガラス框戸程度。 家庭用ステンレス流し台X1、洗面化粧台X1 事務室内にパーテーション等で仕切られた男女別の更衣室を設置する。 印刷室側壁に引き戸を設置し、事務室側からのみ鍵の開閉ができること。 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 給湯設備: 電気給湯器(家庭用程度) ブラインドを設置すること。 自然光を取り入れた明るい部屋とする。 什器類を機能的に配置するため、柱やパイプスペース等の出っ張りを極力減らすこと。 	
c	B1	2-1	印刷室	物理系4専攻全分野が共通に利用する印刷室	<ul style="list-style-type: none"> 扉: H2,000mm×W850mm(片開き)・W1,250mm(親子開き) 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 	
c	B1	2-2	メールボックス	物理系4専攻全分野が共通に利用するメールボックス	<ul style="list-style-type: none"> 扉: H2,000mm×W850mm(片開き)・W1,250mm(親子開き) 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 	
c	B1	3	ミーティングルーム	物理系事務室職員が利用するミーティングルーム	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側扉: H2,000mm×W1,250mm(親子開き) 事務室側扉: H2,000mm×W850mm(方開き)、全面ガラス(型硝子あるいは半透明フィルム貼り)。 洗面化粧台 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 給湯設備: 電気給湯器(家庭用程度) 	
c	B1	4	講義室1	大学院の講義を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 黒板は左右2面、それぞれ2枚の上下可動式。 照明は黒板灯と前後独立に制御可能な天井灯で、天井灯は照度が可変。 窓の暗幕は前後独立に電動開閉可能。 ワイヤレスマイクを3チャンネル以上使用可能。 教卓とパソコン等を設置するための準備卓を備える。 準備卓は電源、プロジェクターケーブル端子、スピーカー入力端子を備える。 照明制御、暗幕制御、スクリーン制御は、準備卓近くで可能。 扉: H2,000mm×W850mm(片開き) 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 映像音声収納ラックに次の外部配線必要。 <ul style="list-style-type: none"> 1) 非常カット信号(防災アンプより) 2) 校内LAN(2系統)、そのうち一つは遠隔講義専用光ファイバ回線 3) 共聴ライン 映像音声機器収納ラックに電源としてAC100V20A×4回路必要 プロジェクタとPCを接続するための信号線を配線し、そのコネクタ部を電動スクリーン近くの壁面に設ける。 パイプスペースや柱などにより黒板(白板)、スクリーンに隠れが発生しないこと。 空調・換気音は最低限に抑えること。 ロビー側壁面(扉部分を除く全面)に掲示板及び専用照明を設置する。また講義室1と講義室5の掲示板の半数は前面がガラス張り鍵により施錠できること。 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
c	B1	5	講義室5	大学院の講義を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・ホワイトボードは左右2面、それぞれ2枚の上下可動式。 ・照明は黒板灯と前後独立に制御可能な天井灯で、天井灯は照度が可変。 ・窓の暗幕は前後独立に電動開閉可能。 ・ワイヤレスマイクを3チャンネル以上使用可能。 ・教卓とパソコン等を設置するための準備卓を備える。 ・準備卓は電源、プロジェクターケーブル端子、スピーカー入力端子を備える。 ・照明制御、暗幕制御、スクリーン制御は、準備卓近くで可能。 ・黒板灯、講義室前後が独立に制御可能。 ・照度可変。 ・スライディングウォールで分離することを考慮し、前後に分割した講義室の照明制御は前後独立に実施できるようにそれぞれの分割領域内に設けること。 ・扉：H2,000mm×W850mm(片開き) ・空調設備：一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 ・映像音声収納ラックに次の外部配線必要。 1) 非常カット信号(防災アンプより) 2) 校内LAN(2系統)、そのうち一つは遠隔講義専用光ファイバ回線 3) 共聴ライン 映像音声機器収納ラックに電源としてAC100V20A×4回路必要 柱情報ネットワークWGの作成仕様による遠隔講義システム ・プロジェクタとPCを接続するための信号線を配線し、そのコネクタ部を電動スクリーン近くの壁面に設ける。 ・パイプスペースや柱などにより黒板(白板)、スクリーンに隠れが発生しないこと。 ・空調・換気音は最低限に抑えること。 ・ロビー側壁面(扉部分を除く全面)に掲示板及び専用照明を設置する。また講義室1と講義室5の掲示板の半数は前面がガラス張りで見により施錠できること。 	
c	B1	6	倉庫	物理系事務室職員が利用する倉庫	<ul style="list-style-type: none"> ・扉：H2,000mm×W850mm(片開き)・W1,250mm(親子開き)×2(左右両端) ・空調設備：一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 ・給湯設備：電気給湯器(家庭用程度) 	
c	B1	7	材料工学共通研究室	材料工学の共通の研究室	<ul style="list-style-type: none"> ・扉：W1,250mm(親子開き) ・システムキッチン(W1,500程度)。 ・パーティションにて区画(※) ・空調設備：一般的な快適温度を目安とする。 ・家庭用ステンレス流し 	
c	B1	8	ゼミ室	大学院のセミナー、研究会を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・スクリーンに対して前後方向に分割して天井灯を制御可能 ・扉：H2,000mm×W850mm(片開き) ・空調設備：一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 ・プロジェクタとPCを接続するための信号線を配線し、そのコネクタ部を電動スクリーン近くの壁面に設ける。 ・パイプスペースや柱などにより白板、スクリーンに隠れが発生しないこと。 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
c	B1	9	ナノマイクロシステム工学分野院生室		<ul style="list-style-type: none"> 扉: W1,250mm(親子開き) 床: OAフロアH100 システムキッチン(W1,500程度)。 パーティションにて区画(※) 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 家庭用ステンレス流し 	
c	B1	10	ナノメトリックス工学分野院生室		<ul style="list-style-type: none"> 扉: H2,000mm×H850mm(片開き) 床: OAフロアH100 システムキッチン(W1,500程度)。 パーティションにて区画(※) 空調設備: 一般的に快適温度を目安とする。 ミニキッチン 給湯設備: 家庭用湯沸器程度 電気温水器 天井のファクトラインを設置 	
c	B1	11	講義室4	大学院の講義を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 黒板は左右2面、それぞれ2枚の上下可動式。 照明は黒板灯と前後独立に制御可能な天井灯で、天井灯は照度が可変。 窓の暗幕は前後独立に電動開閉可能。 ワイヤレスマイクを3チャンネル以上使用可能。 教卓とパソコン等を設置するための準備卓を備える。 準備卓は電源、プロジェクターケーブル端子、スピーカー入力端子を備える。 照明制御、暗幕制御、スクリーン制御は、準備卓近くで可能。 黒板灯、講義室前後が独立に制御可能。 照度可変。 扉: H2,000mm×W850mm(片開き) 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 映像音声収納ラックに次の外部配線必要。 <ul style="list-style-type: none"> 1) 非常カット信号(防災アンプより) 2) 校内LAN(2系統)、そのうち一つは遠隔講義専用光ファイバ回線 3) 共聴ライン 映像音声機器収納ラックに電源としてAC100V20A×4回路必要。 プロジェクタとPCを接続するための信号線を配線し、そのコネクタ部を電動スクリーン近くの壁面に設ける。 パイプスペースや柱などにより黒板(白板)、スクリーンに隠れが発生しないこと。 空調・換気音は最低限に抑えること。 	
c	B1	12	ゼミ室	大学院のセミナー、研究会を行う。	<ul style="list-style-type: none"> スクリーンに対して前後方向に分割して天井灯を制御可能。 扉: H2,000mm×W850mm(片開き) 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 プロジェクタとPCを接続するための信号線を配線し、そのコネクタ部を電動スクリーン近くの壁面に設ける。 パイプスペースや柱などにより白板、スクリーンに隠れが発生しないこと。 	
c	B1	13	ゼミ室	大学院のセミナー、研究会を行う。	<ul style="list-style-type: none"> スクリーンに対して前後方向に分割して天井灯を制御可能。 扉: H2,000mm×W850mm(片開き) 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 プロジェクタとPCを接続するための信号線を配線し、そのコネクタ部を電動スクリーン近くの壁面に設ける。 パイプスペースや柱などにより白板、スクリーンに隠れが発生しないこと。 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
c	B1	14	ゼミ室	大学院のセミナー、研究会を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・スクリーンに対して前後方向に分割して天井灯を制御可能。 ・扉: H2,000mm×W850mm(片開き) ・空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 ・プロジェクタとPCを接続するための信号線を配線し, そのコネクタ部を電動スクリーン近くの壁面に設ける。 ・パイプスペースや柱などにより白板, スクリーンに隠れが発生しないこと。 	
c	B1	15	ナノマイクロシステム工学分野教授室		<ul style="list-style-type: none"> ・床: タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 	
c	B1	16	ナノマイクロシステム工学分野准教授室		<ul style="list-style-type: none"> ・床: タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 	
c	B1	17	ナノマイクロシステム工学分野助教室		<ul style="list-style-type: none"> ・床: タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 	
c	B1	18	ナノメトリクス工学分野教授室	教授室として使用	<ul style="list-style-type: none"> ・扉: H2,000mm×W850mm(片開き) ・床: タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調設備: 一般的に快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 	
c	B1	19	ナノメトリクス工学分野准教授室	准教授室として使用	<ul style="list-style-type: none"> ・扉: H2,000mm×W850mm(片開き) ・床: タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調設備: 一般的に快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 	
c	B1	20	ナノメトリクス工学分野助教室		<ul style="list-style-type: none"> ・床: タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 	

エリア(室名)			用途	特殊条件	備考	
d	B1	1	量子物理学分野研究室	学生の学修、書類整理や少人数の会議など一般的な教育研究等に用いる。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下への出入口を2箇所設ける。(1250mm親子扉) 床:F1 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台および家庭用ステンレス製流し台を2箇所の扉付近に1つずつ設けること。 ブラインドを設けること。 室内壁面(4面)にそれぞれコンセント(4E型, 100V15A)を6箇所づつ等間隔に設けること。(合計24コンセント)。 床コンセント:部屋の南側(廊下寄り)に、廊下と平行かつ等間隔に4箇所配置すること。参考図を参照のこと。 	
d	B1	2	量子ビーム科学講座研究室	学生の学修、書類整理や少人数の会議など一般的な教育研究等に用いる。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下への出入口を2箇所設ける。(1250mm親子扉) 床:F1 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台および家庭用ステンレス製流し台を2箇所の扉付近に1つずつ設けること。 ブラインドを設けること。 室内壁面(4面)にそれぞれコンセント(4E型, 100V15A)を6箇所づつ等間隔に設けること。(合計24コンセント)。 床コンセント:部屋の南側(廊下寄り)に、廊下と平行かつ等間隔に4箇所配置すること。参考図を参照のこと。 	
d	B1	3	量子物理学分野教授室	教員室として書類整理や少人数の会議など一般的な職務等に用いる。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側出入口を1箇所設ける。(1250mm親子扉) 床:タイルカーペット+F1 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 ブラインドを設けること。 	
d	B1	4	量子物理学分野教員室	教員室として書類整理や少人数の会議など一般的な職務等に用いる。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側出入口を1箇所設ける。(1250mm親子扉) 床:タイルカーペット+F1 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 ブラインドを設けること。 	
d	B1	5	量子物理学分野准教授室	教員室として書類整理や少人数の会議など一般的な職務等に用いる。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側出入口を1箇所設ける。(1250mm親子扉) 床:タイルカーペット+F1 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 ブラインドを設けること。 	
d	B1	6	量子ビーム科学講座准教授室	教員室として書類整理や少人数の会議など一般的な職務等に用いる。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側出入口を1箇所設ける。(1250mm親子扉) 床:タイルカーペット+F1 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 ブラインドを設けること。 	
d	B1	7	量子ビーム科学講座教員室	教員室として書類整理や少人数の会議など一般的な職務等に用いる。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側出入口を1箇所設ける。(1250mm親子扉) 床:タイルカーペット+F1 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 ブラインドを設けること。 	
d	B1	8	量子ビーム科学講座教授室	教員室として書類整理や少人数の会議など一般的な職務等に用いる。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側出入口を1箇所設ける。(1250mm親子扉) 床:タイルカーペット+F1 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 ブラインドを設けること。 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
d	B1	9	量子理工(協力講座)教授室	教員室として書類整理や少人数の会議など一般的な職務等に用いる。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側出入口を1箇所設ける。(1250mm親子扉) 床:タイルカーペット+F1 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 ブラインドを設けること。 	
d	B1	10	量子理工(協力講座)准教授室(1)	教員室として書類整理や少人数の会議など一般的な職務等に用いる。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側出入口を1箇所設ける。(1250mm親子扉) 床:タイルカーペット+F1 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 ブラインドを設けること。 	
d	B1	11	量子理工(協力講座)准教授室(2)	教員室として書類整理や少人数の会議など一般的な職務等に用いる。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側出入口を1箇所設ける。(1250mm親子扉) 床:タイルカーペット+F1 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 ブラインドを設けること。 	
d	B1	12	量子理工(協力講座)教員室	教員室として書類整理や少人数の会議など一般的な職務等に用いる。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側出入口を1箇所設ける。(1250mm親子扉) 床:タイルカーペット+F1 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 ブラインドを設けること。 	
d	B1	13	専任講師室(2)	教員室として書類整理や少人数の会議など一般的な職務等に用いる。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側出入口を1箇所設ける。(1250mm親子扉) 床:タイルカーペット+F1 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 ブラインドを設けること。 	
d	B1	14-1	給湯室	会議用等の湯茶の準備、食器洗浄等を行う。廊下との間に扉は設けない。	<ul style="list-style-type: none"> 給湯室奥に更衣室を設けること。 家庭用ステンレス流し台 分電盤:単相100V・40Aを1箇所。 	
d	B1	14-2	更衣室	有害薬品およびガスを取り扱う際の防護服等の着用に用いる。	<ul style="list-style-type: none"> 給湯室奥に位置し、廊下から直接出入はしない。(廊下との出入口は設けない) 靴脱ぎ場0.5x1.5m程度を設け、15cm程度高くしたタイルカーペット床(+F1)とすること。 扉:幅900mm程度のスライド扉(給湯室へ。片開き、鍵付) 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 ブラインドを設けること。 換気扇を設けること。 	
d	B1	15	非常勤講師室	教員室として書類整理や少人数の会議など一般的な職務等に用いる。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側出入口を1箇所設ける。(1250mm親子扉) 床:タイルカーペット+F1 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 ブラインドを設けること。 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
d	B1	16	専任講師室(1)	教員室として書類整理や少人数の会議など一般的な職務等に用いる。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側出入口を1箇所設ける。(1250mm親子扉) 床:タイルカーペット+F1 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 ブラインドを設けること。 	
d	B1	17	ゼミ室	大学院のセミナー、研究会を行う。	<ul style="list-style-type: none"> スクリーンに対して前後方向に分割して天井灯を制御可能 扉:H2,000mm×W850mm(片開き) 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 プロジェクタとPCを接続するための信号線を配線し、そのコネクタ部を電動スクリーン近くの壁面に設ける。 パイプスペースや柱などにより白板、スクリーンに隠れが発生しないこと。 	
d	B1	18	客員研究室2	工学研究科の客員教員・研究員のための研究室	<ul style="list-style-type: none"> 扉:W1,250mm(親子開き) 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 家庭用ステンレス流し 	
d	B1	19	客員研究室1	工学研究科の客員教員・研究員のための研究室	<ul style="list-style-type: none"> 扉:W1,250mm(親子開き) 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 家庭用ステンレス流し 	
d	B1	20	メカトロニクス分野院 生室	学生の居室 教授室、准教授室、助教・秘書室と対面で配置 (入り口が廊下を挟んで対面になるように配置)	<ul style="list-style-type: none"> 扉:W1,250mm(親子開き) 床:OAフロアH100 システムキッチン(W1,500程度)。 パーティションにて区画(※) 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 給湯設備:家庭用湯沸器程度 電気温水器 洗面化粧台 可能であれば天井には格子状にリーラーコンセントを設置。 天井にネットワーク配線用のレースを敷設する。 廊下に展示パネル用レール(4m)。 	
d	B1	21	会議室	専攻内の会議等に用いる。 左記特殊条件以外の機器装備等の仕様等は、機械系会議室のそれに準ずるものとする。	<ul style="list-style-type: none"> 天井固定式プロジェクター用に天井内補強を要する。 壁はめ込みスクリーン用に壁下地補強要。 天井灯:スクリーンに対して前後方向に分割して制御可能であること。照度のコントロールが可能であること。 扉:W1,800mm(両開き) 出入口扉を部屋の西寄り、スクリーンを東側壁に設ける。 極めて防音性の高い壁、天井を用いること。 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 分電盤:単相100V・30A x3 を1箇所。 	
d	B1	22	外国人研究室	教員室として書類整理や少人数の会議など一般的な職務等に用いる。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側出入口を1箇所設ける。(1250mm親子扉) 床:タイルカーペット+F1 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 ブラインドを設けること。 	

エリア(室名)			用途	特殊条件	備考
d	B1	23 客員研究室	教員室として書類整理や少人数の会議など一般的な職務等に用いる。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側出入口を1箇所設ける。(1250mm親子扉) 床: タイルカーペット+F1 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 ブラインドを設けること。 	
d	B1	24 共通管理室	文書などの管理、書類整理に用いる。	<ul style="list-style-type: none"> 扉: 廊下出入り口 W1,250mm(親子開き)を2箇所 パーティション(遮音)にて部屋を半分(25㎡)に区切り、教員室と同等の仕様にする。両部屋に操作が独立した空調設備を1つずつ(2基)設けること。一般的な快適温度を目安とする。 壁面に本棚を設置すること。設置場所は参考図を参照のこと。但し、パーティション壁に、棚等を固定しないこと。また配管の出っ張りなどがないようにすること。 洗面化粧台2箇所 ブラインドを設けること。 	
d	B1	25 客員教員室1	工学研究科の客員教員・研究員のための居室	<ul style="list-style-type: none"> レイアウトは、機械系25㎡居室のそれに準ずるものとする。 扉: W1,250mm(親子開き) 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 	
d	B1	26 客員教員室2	工学研究科の客員教員・研究員のための居室	<ul style="list-style-type: none"> レイアウトは、機械系25㎡居室のそれに準ずるものとする。 扉: W1,250mm(親子開き) 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 	
d	B1	27 メカトロニクス分野教授室	<p>助教室と連結すること。 准教授室 助教室 教授室はこの順で連結すること。 可能であれば床に2箇所程度コンセントを設置したい。 院生室と対面するように配置。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 扉: W1,250mm(親子開き) 床: タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は連結するドア(片開き)を設置。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 	
d	B1	28 メカトロニクス分野助教室	<p>教授室、准教授室と連結させる。 院生室と対面するように配置。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 扉: W 1,250mm(親子開き) 床: タイルカーペット。 システムキッチン(W1,500程度)。 教授室、助教室、准教授室間の壁は連結するドア(片開き)を設置。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 給湯設備: 家庭用湯沸器程度 電気温水器 洗面化粧台 	
d	B1	29 メカトロニクス分野准教授室	<p>助教室と連結すること。准教授室 助教室 教授室はこの順で連結すること。 院生室と対面するように配置。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 扉: W1,250(親子開き) 床: タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は連結するドア(片開き)を設置。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 	

エリア(室名)			用途	特殊条件	備考	
d	B1	30	シャワー室	物理系4専攻の教職員が利用するシャワー室	<ul style="list-style-type: none"> 床: 防水、防かび 壁: 防水、防かび 天井: 防水、防かび シャワーユニット最低2ヶ所 それぞれのユニットに脱衣場、緊急時に防災センター、事務室につながる警報 給湯設備: シャワー用給水 	
a	1	1	生産システム工学分野実験室②	機械システムに関するシミュレーション研究を行うための並列計算機・ワークステーション・パソコンを配置する。	<ul style="list-style-type: none"> 扉: W1,250mm(親子開き) 床: OAフロアH150 多数のPC用電源(100Vx50) 	
a	1	2	生産システム工学分野実験室①	ワークステーションを用いて、生産システムの設計および運用に関するシミュレーション実験、得られたデータの統計処理などを行う。 また、生産システムに関連する種々の被験者実験や、コンピュータ実験と組み合わせた参加型シミュレーションを行う。 できるだけ生産システム工学分野の教員居室および研究室に近いこと。	<ul style="list-style-type: none"> 扉: W1,250mm(親子開き) 床: OAフロアH150 空調: 一般的な快適温度を目安とする。(夏期26℃、冬期22℃) 被験者実験の協力者に湯茶等の提供が必要(ミニキッチン) 消費電力と廃熱が膨大であるため大きな電源容量と強力な空調設備が不可欠である。 	
a	1	3	協力講座配属学生控室	機械系専攻の協力講座配属学生の控え室	<ul style="list-style-type: none"> 扉: W1,250mm(親子開き) 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 家庭用ステンレス流し 	
a	1	4	会議室	会議室	<ul style="list-style-type: none"> 扉: H2,000mm×W1,250mm(親子開き) 天井固定式プロジェクター用に天井内補強要。 壁はめ込みスクリーン用に壁下地補強要。 壁はめ込みホワイトボード。 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 	
a	1	5	産学連携室	産学連携室	<ul style="list-style-type: none"> 扉: H2,000mm×W1,250mm(親子開き) ミニキッチン(コンロなし、水切棚付き) 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 家庭用ステンレス製流し 	
a	1	6	最適システム設計工学分野実験室②	機械システムに関するシミュレーション研究を行うための並列計算機・ワークステーション・パソコンを配置する。	<ul style="list-style-type: none"> 扉: W1,250mm(親子開き) 床: OAフロアH150 多数のPC用電源(100Vx50) 	
a	1	7	最適システム設計工学分野実験室①	ワークステーションを用いて、生産システムの設計および運用に関するシミュレーション実験、得られたデータの統計処理などを行う。 また、生産システムに関連する種々の被験者実験や、コンピュータ実験と組み合わせた参加型シミュレーションを行う。 できるだけ最適システム設計工学分野の教員居室および研究室に近いこと。	<ul style="list-style-type: none"> 扉: W1,250mm(親子開き) 床: OAフロアH150 特殊空調設備: 計算機は終日運転され、発熱量が膨大であるため、通年で独立タイプの24時間空調を必要とする。 結露しないことが必要。 温度18℃±2℃ ミニキッチン バックアップ電源及び電源電圧の安定化が必要 消費電力と廃熱が膨大であるため大きな電源容量と強力な空調設備が不可欠である。 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
a	1	8	協力講座教員控室	機械系専攻の協力講座配属教員の控え室	<ul style="list-style-type: none"> レイアウトは、機械系25㎡居室のそれに準ずるものとする。 扉: W1,250mm(親子開き) 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 	
a	1	9	会議室	会議室	<ul style="list-style-type: none"> 扉: ・W1,250mm(親子開き) 天井固定式プロジェクター用に天井内補強要。 壁はめ込みスクリーン用に壁下地補強要。 天井固定式スクリーン用。 情報コンセントAタイプ×2 桂情報ネットワークWGの作成仕様による遠隔会議システム 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 流し: 洗面化粧台 多数のPC用電源(100Vx60) 	
b	1	1	医療工学分野院生室		<ul style="list-style-type: none"> 扉: W1,250mm(親子開き) 床: OAフロアH100 システムキッチン(W1,500程度)。 パーティションにて区画(※) 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 都市ガス設備: 実験用に必要。 給湯設備: 家庭用湯沸器程度 電気温水器 	
b	1	2	最適システム設計工学分野院生室		<ul style="list-style-type: none"> 扉: ・W1,250mm(親子開き) 情報コンセントAタイプ×2 システムキッチン(W1,500程度)。 パーティションにて区画(※) 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 多数のPC用電源(100Vx60) 	
b	1	3	医療工学分野教授室		<ul style="list-style-type: none"> 床: タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 システムキッチン(W1,500程度)。 パーティションにて区画(※) 給湯設備: 家庭用湯沸器程度 電気温水器 	
b	1	4	医療工学分野准教授室		<ul style="list-style-type: none"> 床: タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
b	1	5	医療工学分野助教室		<ul style="list-style-type: none"> 扉: W1,250mm(親子開き) 床: タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 	
b	1	6	最適システム設計工学分野教授室		<ul style="list-style-type: none"> 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 床: タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 PC用電源(100V×20) 	
b	1	7	最適システム設計工学分野准教授室		<ul style="list-style-type: none"> 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 床: タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 PC用電源(100V×20) 	
b	1	8	最適システム設計工学分野助教室		<ul style="list-style-type: none"> 床: タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 PC用電源(100V×20) 	
b	1	9	生産システム工学分野院生室		<ul style="list-style-type: none"> 扉: ・W1,250mm(親子開き) 情報コンセントAタイプ×2 床: OAフロアH100 システムキッチン(W1,500程度)。 パーティションにて区画(※) 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 	
b	1	10	熱材料工学分野院生室		<ul style="list-style-type: none"> 床は標準仕様 システムキッチン(W1,500程度)。 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 	
b	1	11	招聘外国人研究室2	機械系専攻の招聘外国人研究室	<ul style="list-style-type: none"> 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 	
b	1	12	環境熱流体工学分野院生室		<ul style="list-style-type: none"> 床: OAフロアH100 システムキッチン(W1,500程度)。 パーティションにて区画(※) 部屋内のLAN コンセントのうち1つはKUINS-II とする。 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
b	1	13	流体物理学分野院 生室		<ul style="list-style-type: none"> 床: OAフロアH100 システムキッチン(W1,500程度)。 パーティションにて区画(※) 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 	
b	1	14	生産システム工学分 野教授室		<ul style="list-style-type: none"> 床: タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 PC用電源(100V×20) 	
b	1	15	生産システム工学分 野准教授室		<ul style="list-style-type: none"> 床: タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 PC用電源(100V×20) 	
b	1	16	生産システム工学分 野助教室		<ul style="list-style-type: none"> 床: タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 PC用電源(100V×20) 	
b	1	17	熱材料力学分野教 授室		<ul style="list-style-type: none"> 床: タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 教授室・助教室間開口(W900mm程度)。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 	
b	1	18	熱材料力学分野准 教授室		<ul style="list-style-type: none"> 床: タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 准教授室・助教室間開口(W900mm程度)。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 	
b	1	19	熱材料力学分野助 教室		<ul style="list-style-type: none"> 床: タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 教授室・助教室間開口(W900mm程度)。 准教授室・助教室間開口(W900mm程度)。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
b	1	20	環境熱流体工学分野教授室		<ul style="list-style-type: none"> 床:タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は扉設置。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 	
b	1	21	環境熱流体工学分野准教授室		<ul style="list-style-type: none"> 床:タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は扉設置。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 	
b	1	22	環境熱流体工学分野助教室		<ul style="list-style-type: none"> 床:タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は扉設置。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 	
b	1	23	流体物理学分野教授室		<ul style="list-style-type: none"> 床:タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 	
b	1	24	流体物理学分野准教授室		<ul style="list-style-type: none"> 床:タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 	
b	1	25	流体物理学分野助教室		<ul style="list-style-type: none"> 床:タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 	
b	1	26	コピー室2	コピー室	<ul style="list-style-type: none"> 空調:一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 	
c	1	1	材料物性学分野院生室		<ul style="list-style-type: none"> 部屋内のLAN コンセントのうち1つはKUINS-IIに変更。とする。(理由:サーバー機設置のため。) 床:OAフロアH100 システムキッチン(W1,500程度)。 パーティションにて区画(※) 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 給湯設備:家庭用湯沸器程度 瞬間湯沸し器を設置。 廊下に展示パネル用レール(4m)。 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
c	1	2	適応材料力学分野 院生室	院生の居室。 実験結果の解析やシミュレーションに必要なOA機器を設置する。 教員居室と隣接もしくは向かい合うことが望ましい。 また、実験が長期数日に渡り、頻繁に実験室と居室を往復するため近いほうが良い。	<ul style="list-style-type: none"> ・KUINS-IIおよびKUINS-III、電話を必要とする ・計算機室と居室を結ぶ専用高速回線の情報コンセント ・防音壁 ・換気吸気口にクラス100,000のフィルターを設置 ・扉:W1,250mm(親子開き) ・床:タイルカーペット ・システムキッチン(W1,500程度)。 ・パーティションにて区画(※) ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・家庭用ステンレス製流し ・給湯設備:家庭湯沸器程度(会議に必要な給湯設備) ・計算機室と居室を結ぶ専用高速回線(CAT7)が必要 	
c	1	3	材料物性学分野教授室		<ul style="list-style-type: none"> ・標準仕様のを希望します。 ・床:タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 	
c	1	4	材料物性学分野准教授室		<ul style="list-style-type: none"> ・床:タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 	
c	1	5	材料物性学分野助教室		<ul style="list-style-type: none"> ・床:タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 	
c	1	6	適応材料力学分野教授室		<ul style="list-style-type: none"> ・床:タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 	
c	1	7	適応材料力学分野准教授室		<ul style="list-style-type: none"> ・床:タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 	
c	1	8	適応材料力学分野助教室		<ul style="list-style-type: none"> ・KUINS-IIおよびKUINS-III、電話を必要とする ・床:タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 	

エリア(室名)			用途	特殊条件	備考	
c	1	9	固体力学分野院生室		<ul style="list-style-type: none"> ・教授室、助教室、准教授室及び院生室は同ブロックに隣接または廊下を挟んで配置されること ・床:OAフロアH100 ・システムキッチン(W1,500程度)。 ・パーティションにて区画(※) ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 	
c	1	10	振動工学分野院生室	<p>パソコンによる論文作成・データ処理、研究者・学生との討論、研究補助員の作業スペース部屋を2分割して使用する場合があります。</p> <p>廊下への出入口を2箇所設け、パーティションにて部屋を半分に区切ることができるようなもの(レール等)を、廊下と垂直な方向に設ける。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・扉:W1,250mm(親子開き) ・床:OAフロアH100 ・システムキッチン(W1,500程度)。 ・パーティションにて区画(※) ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 ・パーティションの両側に操作が独立したエアコンをそれぞれ設ける。 	
c	1	11	精密計測加工学分野院生室		<ul style="list-style-type: none"> ・床:OAフロアH100 ・システムキッチン(W1,500程度)。 ・パーティションにて区画(※) ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 	
c	1	12	機械機能要素工学分野院生室	<p>教授室・准教授室・助教室(3部屋)と隣接あるいは近くにあること</p> <p>ワークステーション・パソコンでのシミュレーション、データ処理、設計、および、文献・調査資料を用いた研究等を行う。</p> <p>また、マイクロ機器の運転試験を行う。</p> <p>大学院生が研究室を使う。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・扉:幅は(1,700)mm必要である ・床:タイルカーペット ・システムキッチン(W1,500程度)。 ・パーティションにて区画(※) ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。(夏期26℃、冬期22℃) ・家庭用ステンレス製流し ・給湯設備:家庭用湯沸器程度 ・瞬間湯沸し器を設置。 	
c	1	13	固体力学分野教授室		<ul style="list-style-type: none"> ・教授室、助教室、准教授室及び院生室は同ブロックに隣接または廊下を挟んで配置されること ・床:タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 	
c	1	14	固体力学分野准教授室		<ul style="list-style-type: none"> ・教授室、助教室、准教授室及び院生室は同ブロックに隣接または廊下を挟んで配置されること ・床:タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
c	1	15	固体力学分野助教室		<ul style="list-style-type: none"> ・助教、研究員、秘書が用いる複数のコンピュータを配置する必要があるため電源容量を強化し、20Aを10系統以上とする。また、それに対応できる空調設備を必要とする。 ・教授室、助教室、准教授室及び院生室は同ブロックに隣接または廊下を挟んで配置されること ・床:タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 	
c	1	16	振動工学分野教授室	文献・調査資料を用いた研究、パソコンによるデータ処理、研究者・学生との討論を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・扉:W1,250mm(親子開き) ・床:タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 	
c	1	17	振動工学分野准教授室	文献・調査資料を用いた研究、パソコンによるデータ処理、研究者・学生との討論を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・床:タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 	
c	1	18	振動工学分野助教室	文献・調査資料を用いた研究、パソコンによるデータ処理、研究者・学生との討論を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・床:タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 	
c	1	19	精密計測加工学分野教授室		<ul style="list-style-type: none"> ・床:タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 	
c	1	20	精密計測加工学分野准教授室		<ul style="list-style-type: none"> ・床:タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 	
c	1	21	精密計測加工学分野助教室		<ul style="list-style-type: none"> ・床:タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 	
c	1	22	機械機能要素工学分野教授室		<ul style="list-style-type: none"> ・床:タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 	

エリア(室名)			用途	特殊条件	備考	
c	1	23	機械機能要素工学分野准教授室		<ul style="list-style-type: none"> 床:タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 	
c	1	24	機械機能要素工学分野助教室	教授室・准教授室・助教室と院生室は隣接あるいは近くに配置すること。 文献・調査資料を用いた研究、パソコンによるデータ処理、設計等を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 床:タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 研究データ保存用装置保護のためにエアフィルタを設置。 標準的な電源コンセントに加えて、100V30A-E付の電源コンセントを設置する。 電気瞬間湯沸し器を設置。 	
d	1	1	量子制御工学分野研究室	学生の学修、書類整理や少人数の会議など一般的な教育研究等に用いる。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下への出入口を2箇所設ける。(1250mm親子扉) 床:F1 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台および家庭用ステンレス製流し台を2箇所の扉付近に1つずつ設けること。 ブラインドを設けること。 室内壁面(4面)にそれぞれコンセント(4E型、100V15A)を6箇所づつ等間隔に設けること。(合計24コンセント)。 床コンセント:部屋の南側(廊下寄り)に、廊下と平行かつ等間隔に4箇所配置すること。参考図を参照のこと。 	
d	1	2	核エネルギー変換工学分野研究室	学生の学修、書類整理や少人数の会議など一般的な教育研究等に用いる。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下への出入口を2箇所設ける。(1250mm親子扉) 床:F1 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台および家庭用ステンレス製流し台を2箇所の扉付近に1つずつ設けること。 ブラインドを設けること。 室内壁面(4面)にそれぞれコンセント(4E型、100V15A)を6箇所づつ等間隔に設けること。(合計24コンセント)。 床コンセント:部屋の南側(廊下寄り)に、廊下と平行かつ等間隔に4箇所配置すること。参考図を参照のこと。 	
d	1	3	量子制御工学分野教授室	教員室として書類整理や少人数の会議など一般的な職務等に用いる。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側出入口を1箇所設ける。(1250mm親子扉) 床:タイルカーペット+F1 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 ブラインドを設けること。 	
d	1	4	量子制御工学分野教員室	教員室として書類整理や少人数の会議など一般的な職務等に用いる。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側出入口を1箇所設ける。(1250mm親子扉) 床:タイルカーペット+F1 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 ブラインドを設けること。 	
d	1	5	量子制御工学分野准教授室	教員室として書類整理や少人数の会議など一般的な職務等に用いる。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側出入口を1箇所設ける。(1250mm親子扉) 床:タイルカーペット+F1 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 ブラインドを設けること。 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
d	1	6	核エネルギー変換工学分野准教授室	教員室として書類整理や少人数の会議など一般的な職務等に用いる。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側出入口を1箇所設ける。(1250mm親子扉) 床:タイルカーペット+F1 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 ブラインドを設けること。 	
d	1	7	核エネルギー変換工学分野教員室	教員室として書類整理や少人数の会議など一般的な職務等に用いる。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側出入口を1箇所設ける。(1250mm親子扉) 床:タイルカーペット+F1 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 ブラインドを設けること。 	
d	1	8	核エネルギー変換工学分野教授室	教員室として書類整理や少人数の会議など一般的な職務等に用いる。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側出入口を1箇所設ける。(1250mm親子扉) 床:タイルカーペット+F1 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 ブラインドを設けること。 	
d	1	9	中性子工学分野研究室	学生の学修、書類整理や少人数の会議など一般的な教育研究等に用いる。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下への出入口を2箇所設ける。(1250mm親子扉) 床:F1 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台および家庭用ステンレス製流し台を2箇所の扉付近に1つずつ設けること。 ブラインドを設けること。 室内壁面(4面)にそれぞれコンセント(4E型, 100V15A)を6箇所ずつ等間隔に設けること。(合計24コンセント)。 床コンセント:部屋の南側(廊下寄り)に、廊下と平行かつ等間隔に4箇所配置すること。参考図を参照のこと。 	
d	1	10	核材料工学分野研究室	学生の学修、書類整理や少人数の会議など一般的な教育研究等に用いる。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下への出入口を2箇所設ける。(1250mm親子扉) 床:F1 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台および家庭用ステンレス製流し台を2箇所の扉付近に1つずつ設けること。 ブラインドを設けること。 室内壁面(4面)にそれぞれコンセント(4E型, 100V15A)を6箇所ずつ等間隔に設けること。(合計24コンセント)。 床コンセント:部屋の南側(廊下寄り)に、廊下と平行かつ等間隔に4箇所配置すること。参考図を参照のこと。 	
d	1	11	中性子工学分野教授室	教員室として書類整理や少人数の会議など一般的な職務等に用いる。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側出入口を1箇所設ける。(1250mm親子扉) 床:タイルカーペット+F1 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 ブラインドを設けること。 	
d	1	12	中性子工学分野教員室	教員室として書類整理や少人数の会議など一般的な職務等に用いる。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側出入口を1箇所設ける。(1250mm親子扉) 床:タイルカーペット+F1 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 ブラインドを設けること。 	

エリア(室名)			用途	特殊条件	備考	
d	1	13	中性子工学分野准教授室	教員室として書類整理や少人数の会議など一般的な職務等に用いる。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側出入口を1箇所設ける。(1250mm親子扉) 床:タイルカーペット+F1 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 ブラインドを設けること。 	
d	1	14	核材料工学分野准教授室	教員室として書類整理や少人数の会議など一般的な職務等に用いる。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側出入口を1箇所設ける。(1250mm親子扉) 床:タイルカーペット+F1 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 ブラインドを設けること。 	
d	1	15	核材料工学分野教員室	教員室として書類整理や少人数の会議など一般的な職務等に用いる。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側出入口を1箇所設ける。(1250mm親子扉) 床:タイルカーペット+F1 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 ブラインドを設けること。 	
d	1	16	核材料工学分野教授室	教員室として書類整理や少人数の会議など一般的な職務等に用いる。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側出入口を1箇所設ける。(1250mm親子扉) 床:タイルカーペット+F1 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 ブラインドを設けること。 	
b	2	1	航空宇宙資料室1	資料の保管、閲覧を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 図中の⑪(配線用レール)は省く 扉:H2,000mm×W850mm(片開き) OAフロアとしない システムキッチン(W1,500程度)。 パーティションにて区画(※)【補足】配置図のようにB室を設ける 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台(食器等の洗浄のため) 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 床:タイルカーペット。 空調:一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 給湯設備:家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	
b	2	2	航空宇宙資料室2 (兼産学連携室)	資料の保管、閲覧を行う。 産学連携のための打合せを行う。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 床:タイルカーペット。 空調:一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 洗面台 給湯設備:家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	
b	2	3	航空宇宙共同打合せ室	共同研究の打合せなどを行う。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 床:タイルカーペット。 空調:一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 洗面台 給湯設備:家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
b	2	4	航空宇宙女子更衣室	女性が作業等のために更衣を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 床:タイルカーペット。 空調:一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 洗面台 給湯設備:家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	
b	2	5	航空宇宙複写室	コピー機を用いた資料作成、プロッターを用いた出力などを行う。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 床:タイルカーペット。 空調:一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 洗面台 給湯設備:家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	
b	2	6	航空宇宙外国人講師室1	外国人講師が滞在し、講演準備、研究、ディスカッションなどを行う。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 床:タイルカーペット。 空調:一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 洗面台 給湯設備:家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	
b	2	7	航空宇宙外国人講師室2	外国人講師が滞在し、講演準備、研究、ディスカッションなどを行う。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 床:タイルカーペット。 空調:一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 洗面台 給湯設備:家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	
b	2	8	航空宇宙外国人講師室3	外国人講師が滞在し、講演準備、研究、ディスカッションなどを行う。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 床:タイルカーペット。 空調:一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 洗面台 給湯設備:家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	
b	2	9	航空宇宙会議室	会議を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 床:タイルカーペット。 空調:一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 洗面台 給湯設備:家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	
b	2	10	制御工学分野研究室	大学院生並びに学部生が、システム制御工学に関する研究を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 扉:H2,000mm×W1,250mm(親子開き) 床:OAフロアH100 システムキッチン(W1,500程度)。 パーティションにて区画(※) 空調:一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 家庭用ステンレス製洗面台 給湯設備:家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
b	2	11	航空宇宙大学院生室	A室では、文献・調査資料を用いた研究、パソコンによるデータ処理、研究者・学生との討論を行う。 B室では、文献・調査資料を用いた研究、パソコンによるデータ処理・研究補助業務を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 床：標準フロア システムキッチン(W1,500程度)。 パーティションにてA室とB室に区画(※) 空調：一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) B室は単独空調 給湯設備：家庭用湯沸器程度・電気温水器) A室天井にケーブルラックを布設 B室には単独の電話回線を設置 	
b	2	12	推進工学分野院生室	A室では、文献・調査資料を用いた研究、パソコンによるデータ処理、研究者・学生との討論を行う。 B室では、文献・調査資料を用いた研究、パソコンによる数値計算・データ処理・研究補助業務等を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 全体を、ハイパーパーティションによって、A・Bの2室に分離する。エアコンは、A・B室で独立に制御可能とする。 A室の天井に、ネットワーク配線用のレールを敷設する。 B室には、独立した電話線を設置。複合コピー機を置くため、電源コンセントを増設する。また、数値計算用PCを複数台設置するため電流容量を大きく(>60A)確保する。 扉：H2,000mm×W850mm(片開き) 床：OAフロアH100 システムキッチン(W1,500程度)。 パーティションにて区画(※) 空調：一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 洗面台 給湯設備：家庭用湯沸器程度・電気温水器) ネットワークについては、高速ネットワークが必要なので、CAT7を使用する。 	
b	2	13	航空宇宙共同研究員室1	共同研究員が滞在し、講演準備、研究、ディスカッションなどを行う。	<ul style="list-style-type: none"> 床：タイルカーペット。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調：一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 洗面台 給湯設備：家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	
b	2	14	航空宇宙共同研究員室2	共同研究員が滞在し、講演準備、研究、ディスカッションなどを行う。	<ul style="list-style-type: none"> 床：タイルカーペット。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調：一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 洗面台 給湯設備：家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	
b	2	15	航空宇宙共同研究員室3	共同研究員が滞在し、講演準備、研究、ディスカッションなどを行う。	<ul style="list-style-type: none"> 床：タイルカーペット。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調：一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 洗面台 給湯設備：家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	
b	2	16	制御工学分野教授室	文献・調査資料を用いた研究、パソコンによるデータ処理、研究者・学生との討論を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 扉：H2,000mm×W850mm(片開き) 床：タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調：一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 洗面台 給湯設備：家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	

エリア(室名)			用途	特殊条件	備考	
b	2	17	制御工学分野准教授室	文献・調査資料を用いた研究、パソコンによるデータ処理、研究者・学生との討論を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 扉: H2,000mm×W850mm(片開き) 床: タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調: 一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 洗面台 給湯設備: 家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	
b	2	18	制御工学分野助教室	文献・調査資料を用いた研究、パソコンによるデータ処理、研究者・学生との討論を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 扉: H2,000mm×W850mm(片開き) 床: タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 洗面化粧台 	
b	2	19	航空宇宙力学教授室	文献・調査資料を用いた研究、パソコンによるデータ処理、研究者・学生との討論を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 床: タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調: 一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 洗面台 給湯設備: 家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	
b	2	20	航空宇宙力学准教授室	文献・調査資料を用いた研究、パソコンによるデータ処理、研究者・学生との討論を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 床: タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調: 一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 洗面台 給湯設備: 家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	
b	2	21	航空宇宙力学助教室	文献・調査資料を用いた研究、パソコンによるデータ処理、研究者・学生との討論を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 床: タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調: 一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 洗面台 給湯設備: 家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	
b	2	22	推進工学分野教授室	文献・調査資料を用いた研究、パソコンによるデータ処理、研究者・学生との討論を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 扉: H2,000mm×W850mm(片開き) 床: タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調: 一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 洗面台 給湯設備: 家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	
b	2	23	推進工学分野准教授室	文献・調査資料を用いた研究、パソコンによるデータ処理、研究者・学生との討論を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 扉: H2,000mm×W850mm(片開き) 床: タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調: 一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 洗面台 給湯設備: 家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	

エリア(室名)			用途	特殊条件	備考	
b	2	24	推進工学分野助教室	文献・調査資料を用いた研究、パソコンによるデータ処理、研究者・学生との討論を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 扉：H2,000mm×W850mm(片開き) 床：タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調：一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 洗面台 給湯設備：家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	
c	2	1	構造材料強度学院生室	A室では、文献・調査資料を用いた研究、パソコンによるデータ処理、研究者・学生との討論を行う。 B室では、文献・調査資料を用いた研究、パソコンによるデータ処理・研究補助業務を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 図中の⑦(配線用レール)は省く 扉：H2,000mm×W850mm(片開き) 床：OAフロアとしない。 システムキッチン(W1,500程度)。 パーティションにて区画(※)(パーティションにより配置レイアウト図のようにB室を設ける) 空調設備：一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台(食器等の洗浄のため) 	
c	2	2	流体数理工学分野学生室	文献・調査資料を用いた研究、パソコンによるデータ処理、研究者・学生との討論を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 扉：H2,000mm×W1,250mm(親子開き) 床：OAフロアH100 システムキッチン(W1,500程度)。 パーティションにて区画(※) 空調設備：一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 	
c	2	3	構造材料強度学教授室	文献・調査資料を用いた研究、パソコンによるデータ処理、研究者・学生との討論を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 扉：H2,000mm×W850mm(片開き) 床：タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調設備：一般的な快適温度を目安とする。 洗面台 給湯設備：家庭用湯沸器程度(カップ等の洗浄のため) 	
c	2	4	構造材料強度学准教授室	文献・調査資料を用いた研究、パソコンによるデータ処理、研究者・学生との討論を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 扉：H2,000mm×W850mm(片開き) 床：タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調設備：一般的な快適温度を目安とする。 洗面台 給湯設備：家庭用湯沸器程度(カップ等の洗浄のため) 	
c	2	5	構造材料強度学助教室	文献・調査資料を用いた研究、パソコンによるデータ処理、研究者・学生との討論を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 扉：H2,000mm×W850mm(片開き) 床：タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調設備：一般的な快適温度を目安とする。 洗面台 給湯設備：家庭用湯沸器程度(カップ等の洗浄のため) 	

エリア(室名)			用途	特殊条件	備考	
c	2	6	流体数理学分野教授室	文献・調査資料を用いた研究、パソコンによるデータ処理、研究者・学生との討論を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 扉: H2,000mm×W1,250mm(親子開き) 床: タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調: 一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 洗面台 給湯設備: 家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	
c	2	7	流体数理学分野准教授室	文献・調査資料を用いた研究、パソコンによるデータ処理、研究者・学生との討論を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 扉: H2,000mm×W1,250mm(親子開き) 床: タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調: 一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 洗面台 給湯設備: 家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	
c	2	8	流体数理学分野助教室	文献・調査資料を用いた研究、パソコンによるデータ処理、研究者・学生との討論を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 扉: H2,000mm×W1,250mm(親子開き) 床: タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調: 一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 洗面台 給湯設備: 家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	
c	2	9	分子流体力学分野学生室	A室では、文献・調査資料を用いた研究、パソコンによるデータ処理、研究者・学生との討論を行う。 B室では、文献・調査資料を用いた研究、パソコンによるデータ処理・研究補助業務を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 全体を、ハイパーパーティションによって、A・Bの2室に分離する。エアコンは、A・B室で独立に制御可能とする。 A室の天井に、ネットワーク配線用のレールを敷設する。 B室には、独立した電話線を設置。複合コピー機を置くため、電源コンセントを増設する。 分子流体力学分野実験室(c-B2-16)と、KUINSとは別の高速ネットワークにて直結する。そのための特殊配管を要する。 扉: W1,250mm(親子開き) 書棚などには転倒防止措置を講じる。 各机に⑤パソコンを配置 システムキッチン(W1,500程度)。 パーティションにて区画(※) 空調: 一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 家庭用ステンレス製流し 給湯設備: 家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	
c	2	10	流体力学分野研究室	A室では、文献・調査資料を用いた研究、パソコンによるデータ処理、研究者・学生との討論を行う。 B室では、文献・調査資料を用いた研究、パソコンによるデータ処理・研究補助業務を行う。 シミュレーションラボ1と、KUINSを超える高速なネットワークを用いて接続する必要がある。	<ul style="list-style-type: none"> 扉: H2,000mm×W1,250mm(親子開き) 1.全体を、ハイパーパーティションによって、A・Bの2室に分離する。エアコン・照明は、A・B室で独立に制御可能とする。 2.A室の天井に、配線用のレールを敷設する。 3.計算機操作のため、関連分野教員・流体力学分野実験室とKUINSを超える高速ネットワークで直結する必要がある。 ケーブルは、カテゴリ7を用い、各配線の延長は90m以内である必要がある。 このケーブルは、将来の技術進歩に応じ、容易に交換できるように敷設する必要がある。 4.B室には、独立した電話線を設置。複合コピー機を置くため、電源コンセントを設置する。 システムキッチン(W1,500程度)。 パーティションにて区画(※) 空調: 一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 家庭用ステンレス流し 給湯設備: 家庭用湯沸器程度・電気温水器) 天井面にケーブルラックを設置 	

エリア(室名)			用途	特殊条件	備考	
c	2	11	分子流体力学分野 教授室	文献・調査資料を用いた研究、パソコンによる データ処理、研究者・学生との討論を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・扉: H2,000mm × W850mm(片開き) ・床: タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm × H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調: 一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) ・洗面台 ・給湯設備: 家庭用湯沸器程度・電気温水器) ・分子流体力学分野実験室(c-B2-16)と、KUINSとは別の高速ネットワークにて直結する。そのための特殊配管を要する。 	
c	2	12	分子流体力学分野 准教授室	文献・調査資料を用いた研究、パソコンによる データ処理、研究者・学生との討論を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・扉: H2,000mm × W850mm(片開き) ・床: タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm × H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調: 一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) ・洗面台 ・給湯設備: 家庭用湯沸器程度・電気温水器) ・分子流体力学分野実験室(c-B2-16)と、KUINSとは別の高速ネットワークにて直結する。そのための特殊配管を要する。 	
c	2	13	分子流体力学分野 助教室	文献・調査資料を用いた研究、パソコンによる データ処理、研究者・学生との討論を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・床: タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm × H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調: 一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) ・洗面台 ・給湯設備: 家庭用湯沸器程度・電気温水器) ・分子流体力学分野実験室(c-B2-16)と、KUINSとは別の高速ネットワークにて直結する。そのための特殊配管を要する。 	
c	2	14	流体力学分野教授 室	文献・調査資料を用いた研究、パソコンによる データ処理、研究者・学生との討論を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・床: タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm × H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調: 一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) ・洗面台 ・給湯設備: 家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	
c	2	15	流体力学分野准教 授室	文献・調査資料を用いた研究、パソコンによる データ処理、研究者・学生との討論を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・床: タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm × H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調: 一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) ・洗面台 ・給湯設備: 家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	
c	2	16	流体力学分野助教 室	文献・調査資料を用いた研究、パソコンによる データ処理、研究者・学生との討論を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・床: タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm × H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調: 一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) ・洗面台 ・給湯設備: 家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
b	3	1	ナノ物性工学分野院 生室		<ul style="list-style-type: none"> ・システムキッチン(W1,500程度)。 ・パーティションにて区画(※) ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・給湯設備:家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	
b	3	2	光工学分野院生室		<ul style="list-style-type: none"> ・システムキッチン(W1,500程度)。 ・パーティションにて区画(※) ・空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 ・家庭用ステンレス流し ・給湯設備:家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	
b	3	3	ナノ物性工学分野教 授室		<ul style="list-style-type: none"> ・床:タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調:一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) ・洗面台 	
b	3	4	ナノ物性工学分野准 教授室		<ul style="list-style-type: none"> ・床:タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調:一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) ・洗面台 	
b	3	5	ナノ物性工学分野助 教室		<ul style="list-style-type: none"> ・床:耐薬品性ビニルシート ・単相 100V 30A ・単相 200V 30A ・三相 200V 30A ・実験室への転用を想定し、分電盤(実験盤)を設置。 ・実験に必要な冷却水はチラーで循環(20リットル程度)方式。 ・部屋の中央付近、ドア脇にコンセントを設置。(空調のコンローラや照明のスイッチの足元にコンセントがあると、棚など什器でふさがり可能性が少ないので望ましい。) ・扉:W1,250mm(親子開き)。 ・空調:一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) ・実験用陶器流し、もしくはシステムキッチンなど、小型で底が平らなもの。 	
b	3	6	光工学分野教授室		<ul style="list-style-type: none"> ・床:タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調:一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) ・洗面台 	
b	3	7	光工学分野准教授 室		<ul style="list-style-type: none"> ・床:タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調:一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) ・洗面台 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
b	3	8	光工学分野助教室		<ul style="list-style-type: none"> 床:タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調:一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 洗面台 	
b	3	9	熱工学分野院生室		<ul style="list-style-type: none"> 床:OAフロアH100 システムキッチン(W1,500程度)。 パーティションにて区画(※) 空調:一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 洗面台 給湯設備:家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	
b	3	10-1	熱物理工学分野研究室2	機械理工学専攻・物性工学講座・熱物理工学分野の研究室である。	<ul style="list-style-type: none"> 扉:W1,250mm(親子開き) パーティションにて区画(※) 空調設備:一般的に快適温度を目安とする。 家庭用ステンレス製流し 給湯設備:家庭用湯沸器程度 	
b	3	10-2	熱物理工学分野研究室1	機械理工学専攻・物性工学講座・熱物理工学分野の研究室である。	<ul style="list-style-type: none"> 扉:W1,250mm(親子開き) パーティションにて区画(※) 空調設備:一般的に快適温度を目安とする。 実験用陶器製流し 	
b	3	11	招聘外国人研究室1	機械系専攻の招聘外国人研究室	<ul style="list-style-type: none"> 空調設備:一般的に快適温度を目安とする。 家庭用ステンレス製流し 給湯設備:家庭用湯沸器程度 	
b	3	12	レンタル		<ul style="list-style-type: none"> 扉:W1,250mm(親子開き) システムキッチン(W1,500程度)。 パーティションにて区画(※) 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 家庭用ステンレス流し 	
b	3	13	熱工学分野教授室		<ul style="list-style-type: none"> 床:タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調:一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 洗面台 給湯設備:家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	
b	3	14	熱工学分野准教授室		<ul style="list-style-type: none"> 床:タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調:一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 洗面台 給湯設備:家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
b	3	15	熱工学分野助教室		<ul style="list-style-type: none"> 床:タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調:一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 洗面台 給湯設備:家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	
b	3	16	熱物理工学分野教授室		<ul style="list-style-type: none"> 床:タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調:一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 洗面台 給湯設備:家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	
b	3	17	熱物理工学分野准教授室		<ul style="list-style-type: none"> 床:タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調:一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 洗面台 給湯設備:家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	
b	3	18	熱物理工学分野助教室		<ul style="list-style-type: none"> 床:タイルカーペット。 教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 空調:一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 洗面台 給湯設備:家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	
b	3	19	レンタル		<ul style="list-style-type: none"> レイアウトは、機械系25㎡居室のそれに準ずるものとする。 扉:W1,250mm(親子開き) 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 	
b	3	20	レンタル		<ul style="list-style-type: none"> レイアウトは、機械系25㎡居室のそれに準ずるものとする。 扉:W1,250mm(親子開き) 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 	
b	3	21	レンタル		<ul style="list-style-type: none"> レイアウトは、機械系25㎡居室のそれに準ずるものとする。 扉:W1,250mm(親子開き) 空調設備:一般的な快適温度を目安とする。 洗面化粧台 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
b	3	22	レンタル		<ul style="list-style-type: none"> ・レイアウトは、機械系25㎡居室のそれに準ずるものとする。 ・扉: W1,250mm(親子開き) ・空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 ・洗面化粧台 	
b	3	23	コピー室1	コピー室	<ul style="list-style-type: none"> ・空調: 一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) 	
c	3	1	マイクロ加工システム分野研究生室		<ul style="list-style-type: none"> ・扉: W1,250mm(親子開き) ・床: OAFフロアH100 ・システムキッチン(W1,500程度)。 ・パーティションにて区画(※) ・空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 ・家庭用ステンレス流し 	
c	3	2	先端イメージング工学分野研究室	イメージング機器、検査機器計5台を設置、実験	<ul style="list-style-type: none"> ・床: OAFフロアH100 ・システムキッチン(W1,500程度)。 ・パーティションにて区画(※) ・空調設備: 一般的な快適温度を目安とする。 ・実験装置用給排水: 水道水供給(装置冷却用) 	
c	3	3	マイクロ加工システム分野教授室		<ul style="list-style-type: none"> ・床: タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調: 一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) ・洗面台 ・給湯設備: 家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	
c	3	4	マイクロ加工システム分野准教授室		<ul style="list-style-type: none"> ・床: タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調: 一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) ・洗面台 ・給湯設備: 家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	
c	3	5	マイクロ加工システム分野助教室		<ul style="list-style-type: none"> ・床: タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調: 一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) ・洗面台 ・給湯設備: 家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	
c	3	6	先端イメージング工学分野教授室		<ul style="list-style-type: none"> ・床: タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調: 一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) ・洗面台 ・給湯設備: 家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	

エリア(室名)				用途	特殊条件	備考
c	3	7	先端イメージング工学分野准教授室		<ul style="list-style-type: none"> ・床:タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調:一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) ・洗面台 ・給湯設備:家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	
c	3	8	先端イメージング工学分野助教室		<ul style="list-style-type: none"> ・床:タイルカーペット。 ・教授室、助教室、准教授室間の壁は将来対応で扉設置可能な補強要。 ・廊下側開口(W1,250mm×H2,100mm程度(親子扉))。 ・空調:一般的な快適温度を目安とする。(標準設計温度 夏期26℃ 冬期22℃) ・洗面台 ・給湯設備:家庭用湯沸器程度・電気温水器) 	